

シングルモ-ド光ファイバ用光コネクタの特性及び製 造に関する研究

メタデータ	言語: ja
	出版者:静岡大学
	公開日: 2012-01-17
	キーワード (Ja):
	キーワード (En):
	作成者: 高橋, 光雄
	メールアドレス:
	所属:
URL	https://doi.org/10.11501/3132506

電子科学研究	2科福	GD
		K
0002513836	R	135
		静岡大学附属図書館

静岡大学 博士論文

シングルモード光ファイバ用光コネクタの 特性及び製造に関する研究





1997年11月

静岡大学大学院電子科学研究科 電子応用工学専攻

高橋 光雄

概要

本論文は、光ファイバ通信システムにおいて使用される、シングルモ -ド光ファイバ用斜め球面研磨光コネクタ(APCコネクタ(Angledphysical-contact optical connector)に関する研究成果をとりまと めたものである.本研究のAPCコネクタは、光コネクタの接続端面か らの反射戻り光を極限にまで低減するために、光コネクタ・フェルール の接続端面を光ファイバ光軸の直角面に対して8度以上の傾斜球面に成 形研磨して構成したものである.

本論文は、APC光コネクタの生産に必要な、光ファイバ端面の斜め 球面研磨装置に関する研究、及びAPC光コネクタの挿入損失特性の改 善に関する研究の二つの主題により構成した.

光ファイバ端面の斜め球面研磨装置に関する研究に関しては,最初 に,公転と自転の複合円軌跡運動をする弾性研磨盤に,固定保持した光 ファイバ付きフェルールを押し付けて行う,新しい光ファイバ端面の斜 め球面成形研磨法について提案し,新しい研磨装置の概要と特徴につい て記述した.次に,本研磨装置により光ファイバ端面の斜め球面に関し て評価実験を行い,その結果から得られた斜め球面成形研磨装置の特性 について記述した.

APCコネクタの挿入損失特性の改善の研究に関しては,最初に,テ -パ・フェルール(Tapered-ferrule)について,斜め球面の形状特性, 及び接続特性の理論解析を行なって,APCコネクタ用フェルールの特 性改善に関する課題を明らかにした.

そこで、テーパ・フェルール付きAPCコネクタの改善課題を解決す るために、APCコネクタ用フェルールとして、フェルール先端部を段 付き直円筒に成形した、新しいステップ・フェルール(Steppedferrule)を提案し、その形状特性と接続特性の理論解析を行うと共に、 接続実験のデータからステップ・フェルール付きAPCコネクタの優位 性を明らかにした。

本研究により提案,実用化した光ファイバ端面の新しい球面研磨装置

i

はAPCコネクタの量産を可能にした.一方,本研究によるステップ・ フェルールを使用したAPCコネクタは国際的に主流になっている.更 に,本研究によるステップ・フェルールは,1997年にIEC 874-14-7, SC/APCコネクタの国際規格に採用された.

目 次

第1章 序 論

1.1 研究の背景	1
1.2 光コネクタの接続損失	3
1.2.1 光コネクタの挿入損失の要因	3
1.2.2 光コネクタの反射戻り光の要因	
1.3 光コネクタ技術の変遷	12
1.4 光ファイバ端面研磨技術の変遷	15
1.4.1 従来の研磨技術	15
1.4.2 公知の鏡面研磨法	
1.5 APCコネクタの研究課題	19
1.5.1 斜め球面成形研磨法及び装置	19
1.5.2 APCコネクタ	21
1.6 本研究の目的と構成	22
第1音 参考文献	0.4
	24
第2章 斜め球面成形研磨法及び研磨装置,並びに研磨特性	24
第2章 斜め球面成形研磨法及び研磨装置,並びに研磨特性 2.1 まえがき	······ 24 ····· 28
 第2章 斜め球面成形研磨法及び研磨装置,並びに研磨特性 2.1 まえがき 2.2 球面成形研磨法の理論 	24 28 28
第2章 斜め球面成形研磨法及び研磨装置,並びに研磨特性 2.1 まえがき 2.2 球面成形研磨法の理論 2.2.1 研磨軌跡	24 28 28 28
 第2章 斜め球面成形研磨法及び研磨装置,並びに研磨特性 2.1 まえがき 2.2 球面成形研磨法の理論 2.2.1 研磨軌跡 2.2.2 研磨盤の公転及び自転の複合運動機構 	24 28 28 28 32
 第2章 斜め球面成形研磨法及び研磨装置,並びに研磨特性 2.1 まえがき 2.2 球面成形研磨法の理論 2.2.1 研磨軌跡 2.2.2 研磨盤の公転及び自転の複合運動機構 2.2.3 研磨領域とフェルールの配置 	24 28 28 28 32 34
 第2章 斜め球面成形研磨法及び研磨装置,並びに研磨特性 2.1 まえがき 2.2 球面成形研磨法の理論 2.2.1 研磨軌跡 2.2.2 研磨盤の公転及び自転の複合運動機構 2.2.3 研磨領域とフェルールの配置 2.3 弾性研磨盤による斜め球面成形研磨 	24 28 28 28 32 34 34
 第2章 斜め球面成形研磨法及び研磨装置,並びに研磨特性 2.1 まえがき 2.2 球面成形研磨法の理論	24 28 28 28 32 34 34 35
 第2章 斜め球面成形研磨法及び研磨装置,並びに研磨特性 2.1 まえがき	24 28 28 32 34 34 35 37
 第2章 斜め球面成形研磨法及び研磨装置,並びに研磨特性 2.1 まえがき 2.2 球面成形研磨法の理論	24 28 28 28 32 34 34 35 37 37

2.4.2 研磨盤の駆動機構 38 2.4.3 斜め球面成形研磨装置の実施例 40 . . .

...

2.5 斜め球面成形研磨の評価実験	42
2.5.1 評価実験項目と評価基準	42
2.5.2 評価実験結果	48
2.6 評価実験結果の考察	56
2.6.1 球面の曲率半径と弾性研磨盤のたわみ変形	57
2.6.2 弾性研磨盤による球面成形の限界条件	57
2.6.3 光ファイバ研磨面のフェルール端面からの凹み	62
2.7 まとめ	64
第2章参考文献	66
第3音 テーパ・フェルール付き Δ P C コネクタの解析 -1	
	60
3.1 まえがさ	08
3.2 テーバ・フェルールの形状特性の理論解析	70
3.2.1 斜め塚面頂点の光軸からの偏心の生成機構	70
3.2.2 斜め球面接点の光軸からの偏心及び接触角度	74
3.2.3 光ファイバ端面間のエアギャップ	81
3.3 テーパ・フェルールの接続特性の理論解析	84
3.3.1 光ファイバの接続原理	84
3.3.2 エアギャップの消去に要する接触力	85
3.4 考察	87
3.4.1 斜め球面接点の許容偏心量	87
3.4.2 光軸上のエァギャップによる挿入損失	89
3.5 まとめ	92
第3章参考文献	95
第4章 テーパ・フェルール付きAPCコネクタの解析-2	
フェルール回転角度 $\varphi \ge 0$ 度における接続特性	

	4.2 フ	ェルール回転による形状特性の理論解析	98
	4.2.1	フェルール回転による接続状態の概要	98
	4.2.2	2 斜め球面の接点の光軸からの偏心	100
	4.2.3	斜め球面の接点の光軸に対する接触角度	109
	4.2.4	と 光ファイバ光軸上のエァギャップ	112
	4.3 フ	ェルール回転による接続特性の変化の理論解析	113
	4.4 考	察	118
	4.4.1	テ-パ・フェルールの接続時の許容回転角度	118
	4.4.2	2 斜め球面の接点の光軸からの偏心	120
	4.4.3	3 斜め球面の接点の光軸に対する接触角度	120
	4.4.4	1 フェルールの回転による挿入損失	120
	4.5 ¥	とめ	123
	第	4章参考文献	125
ක්		マニップ・フェリール けんさん PCコラクタの解析	
牙	う 早 ノ 	、テック・クェルール付きAFCコネクタの解析 フェルール回転角度 ∞ ≥ 0 度における接続特性	
	5.1 I	ミえがき	127
	5.2 7	、テップ・フェルールの形状	128
	5.3 7	、テップ・フェル-ル形状特性の理論解析	129
	5.3.	1 斜め球面頂点の光軸からの偏心	129
	5.3.	2 斜め球面接点の光軸からの偏心	131
	5.3.	3 斜め球面の接点の光軸に対する接触角度	140
	5.3.		143
	·	4 光ファイバ端面間のエァキャップ	
	5.4	4 光ファイバ端面間のエァキャップ フェルール回転による接続特性の理論解析	143
	5.4 ⊃ 5.5 ≵	 4 光ファイバ端面間のエァキャップ ウェルール回転による接続特性の理論解析 祭 	143 148
	5.4 5 5.5 ≢ 5.5.	 4 光ファイバ端面間のエァキャップ ケェルール回転による接続特性の理論解析 	143 148 148
	5.4 5.5 ≢ 5.5. 5.5.	 4 光ファイバ端面間のエァキャップ ケェルール回転による接続特性の理論解析 奈 1 ステップ・フェルールの接続時の許容回転角度 2 APCコネクタ用の構成部品仕様の提案 	143 148 148 149
	5.4 5.5 5.5. 5.5. 5.5. 5.5.	 4 光ファイバ端面間のエァキャップ ケェルール回転による接続特性の理論解析 奈 育 察 1 ステップ・フェルールの接続時の許容回転角度 2 APCコネクタ用の構成部品仕様の提案 3 斜め球面の接点の光軸からの偏心 	143 148 148 149 150
	5.4 5.5 5.5. 5.5. 5.5. 5.5. 5.5.	 4 光ファイバ端面間のエァキャップ ケェルール回転による接続特性の理論解析 奈 育 察 1 ステップ・フェルールの接続時の許容回転角度 2 APCコネクタ用の構成部品仕様の提案 3 斜め球面の接点の光軸からの偏心 4 斜め球面の接点の光軸に対する接触角度 	143 148 148 149 150 150

	5.	5.5	フ	ェル	ール	の回	転に	こよる	5挿	入損	長					• • • •	 151
5	.6	まる	とめ									• • • •	• • • •	• • • •			 153
		第5	5章	参考	文献					• • • •			• • • •		• • •		 . 155

第6章 APCコネクタの挿入損失の実験

6 -	1 -	ヒラ	がキ	157
0	La	エん	M ²	101
6.2	2 2	フェ	ルールの形状及び回転角度による挿入損失の比較	158
	6.2.	1	実験試料及び実験方法	158
	6.2.	2	実験データ	161
	6.2.	3	実験結果と考察	166
6.3	3 2	ステ	ップ・フェルールの回転角度と増加挿入損失	173
	6.3.	1	実験試料及び実験方法	173
	6.3.	2	実験データ	175
	6.3.	3	実験結果と考察	177
6.4	4 糸	巣り	返し着脱	178
	6.4.	1	実験試料及び実験方法	178
	6.4.	2	実験結果と考察	179
6.	5 3	まと	Ø	181
	貿	育 6	章参考文献	183

第7章 結 言

7.1 本論文のまとめ	184
7.1.1 斜め球面成形研磨装置	184
7.1.2 APCコネクタの接続特性	185
7.2 本研究成果の実績と応用	189
第7章参考文献	191

本研	究に関する発表論文	192
本研	究内容が採用された IEC 国際規格	193
本研	「究に関連して取得した USA 特許	194
付	録	195
謝	辞	199

第1章 序 論

1.1 研究の背景

光ファイバ通信は、1960年代に要素技術が発明され、1970年代に 始められたばかりである.すなわち、1964年に東北大学の西沢教授ら によって、1本の光ファイバの半径方向に屈折率分布を与える事によ り、レンズ列導波路と同じ様な光の収束効果をもつグレーデッドイン デックス型光ファイバが考案された.その後、1970年に至り、Bell Laboratory (USA)により室温で連続発振する半導体レーザが開発さ れた.さらに同年、低損失光ファイバが Corning 社 (USA) により実 現された.

その後, 光ファイバの低損失化の研究が積み重ねられて, 現在, 市場 に現われている石英系光ファイバの損失は, 波長1.310 μm において 0.3 dB / km 以下, 波長1.550 μm において 0.2 dB / km 以下が達 成されている.

1980年代には、光ファイバ通信の実用化が一気に進み、1985年に はNTTにより日本縦貫光ファイバケーブルが敷設された.更に、1989 年にはKDD(日本)、AT&T(USA)により、太平洋横断光ファイバ ケーブルが完成された[1].

1990年代に入ると, FTTH (Fiber To The Home)の実現が論じ られるようになると共に,その具体化のための光ファイバを使用した回 路システムの実現,通信の高速大容量化,及び関連する各種光デバイス の実用化技術開発が急速に進められるようになった.

光コネクタは,光ファイバ通信の最も早い時期に製作された光ファイ バ用デバイスであった.当初は,同軸ケーブル・コネクタを改造したも のが光コネクタとして使用された.例えば,日本ではFA型光コネクタ, USAではSMA型光コネクタが挙げられる[2],[3].その後,世界各国 で多種多様な構造の光コネクタが考案されてきたが,要求される性能特 性の高度化に伴って,性能及び互換性の点で,単心光ファイバ用コネク タは,ここ数年の間に世界的に数種類に集約された.

1 े



(a). FC type of optical connectors.



図1.1 FC型及びSC型光コネクタの形状

図1.1(a),(b)に, 現時点で, 世界的に最も普及している代表的な単心 光コネクタの例を示す. 図1.1(a)はFC型光コネクタであり, 図1.1(b) はSC型光コネクタである. これらの光コネクタは共に日本のNTTで 開発されたものである[4],[5]. 双方共にフェルールがプラグ・ハウジ ング内部で, コイルばねにより保持された所謂フローチング・フェルー ル (Floating-ferrule)構造を採用している. このため, 振動, 衝撃, 及び引っ張りなどの外力による影響を受け難いので,安定した接続特性 が得られる特徴がある. 整列アダプタからの着脱は, 各々FC光コネク タではカプリング・ナットによるねじ込みにより行い, SC光コネクタ は外側プラグ部品のプッシュ・プルにより行う.

最近に至り,光交換機や多回路用光分岐結合器,ONU(Optical network unit)などの小型化の要望により,新規にMU光コネクタが開発され,一方,高密度光伝送を目的に開発された多心リボンファイバを一括して接続するため,2~16心のMT光コネクタなどが開発された[6],[7].

送信容量も少なく,光ファイバ損失も大きかった光ファイバ通信技術 開発の初期段階では,光コネクタに対する接続特性の要求レベルも低 かった.1980年代に入って光ファイバ通信システム,及び光デバイス 技術の研究開発によるデバイス性能の急速な向上により,大容量通信の 可能性が見えてくるにつれて,光コネクタに対する接続特性の高度化の 要請が年を追って高まってきた.

1.2 光コネクタの接続損失

光コネクタの接続損失は,挿入損失 (Insertion loss)と反射戻り光 (Backreflection of light)による損失に大別される.これらについて 次に概要を述べる.

1.2.1 光コネクタの挿入損失の要因

光コネクタにおける挿入損失に影響する要因を表1.1に示す[8].

3

1) 光ファイバ間の光軸ずれによる挿入損失



表1.1 光コネクタの接続損失に影響する要因

光ファイバ間の光軸ずれによる挿入損失は,一対の光ファイバ付き フェルールを整列スリーブ孔に挿入したときに,双方のフェルールに接 着固定された光ファイバ光軸が一致しない場合に生じる.この主な原因 としては,フェルールの外径に対する中心孔の偏心,及び光ファイバと 中心孔の寸法差による隙間などが挙げられる.シングルモード光フアイ バの場合の光ファイバ間の光軸ずれ d による挿入損失 IL (dB)は,式 (1.1) により与えられる[8].

$$IL_d(dB) = -10\log T \cdot \exp\left[-(d/\omega)^2\right]$$
(1.1)

ただし,

T:光ファイバ間の光透過率,

ω: 光ファイバのモードフィルド半径.

図1.2 光ファイバ間の光軸ずれによる挿入損失ここで、T=0.93、 $\omega = 4.1 \mu m$ と仮定して、光ファイバ間の光軸ずれ d による挿入損失 IL (dB)は、光軸ずれ dが1 μm の場合には約0.23 dB、光軸ずれ d



図1.2 光ファイバ間の光軸ずれによる挿入損失 IL_d

が2 µm の場合には約0.9 dBになる.初期においては,フェルール及 び光ファイバの寸法精度が不十分であったので,接続損失改善のための 最大の課題は光軸ずれであったが,生産技術の進歩により解決され,現 在では1.5 µm 以下に調整できるようになった.このときの挿入損失 *IL*_aは約0.5 dBである.

2) 光ファイバ端面間のエアギャップによるフレネル損失

光ファイバ端面間のエアギャップによる挿入損失は,一対の光ファイ バ端面が密着しない場合に,光ファイバ・コアと空気層との境界におけ る屈折率の差異によって生ずるフレネル損失(Fresnnel loss)が原因 になる.光ファイバ端面が光軸に対して直角の場合のフレネル損失によ る挿入損失 *IL*_Fは,式(1.2)により与えられる[9].

$$IL_{F}(dB) = -10\log\left[16n_{1}^{2}/(1+n_{1})^{2}\right]$$
(1.2)

ただし、n,は光ファイバの光屈折率.

ここで、光ファイバの光屈折率n₁=1.47と仮定すれば、光ファイバ 端面が光軸に対して直角の場合、シングルモ-ド光ファイバについて は、このフレネル損失による挿入損失 IL_Fは約 0.32 dB になる.

3) エアギャップによる多重反射損失

エァギャップzが数µm程度と狭く,かつ,光ファイバ端面が並行面の場合は,光ファイバ端面間において光の多重反射が生じて,挿入損失 IL_R増加の原因になる.この多重反射による挿入損失 IL_Rは式(1.3) により与えられる[10].

$$IL_{R}(dB) = -10\log\left[\frac{a_{0}^{2}(1-r^{2})^{2}}{\left(1-r^{2}\right)^{2}+4r^{2}\cdot\sin^{2}(\delta/2)}\right]$$
(1.3)

ただし,

 $\delta = 4\pi \cdot n \cdot z / \lambda$:光束間の位相差,

- λ:光波長,
- *a*o:振幅,

 $r^{2} = |(n_{1}-1)/(n_{1}+1)|^{2}$:光の反射率.

接続端面が光軸に対して直角の光ファイバの端面間にエァギャップが ある状態で接続された場合,光波長 λ の λ /4に相当するエァギャップ 毎に最大で約 0.6 dBの挿入損失 IL_R を生ずる. この挿入損失 IL_R は 0 dB と 0.6 dB を振幅とする cos 曲線で表わされる.

4) 光ファイバ端面の傾斜角度の差異による挿入損失

光ファイバ端面の傾斜角度の差異による挿入損失 *IL* (dB)は,式 (1.4) により与えられる[11].

$$IL_{\theta} (dB) = -10 \log T \left\{ 1 - \left[\frac{(n_1/n_0) - 1}{\pi \cdot n_1 \sqrt{2\Delta}/n_0} \cdot \theta_1 + \frac{(n_1/n_0) - 1}{\pi \cdot n_1 \sqrt{2\Delta}/n_0} \cdot \theta_2 \right] \right\}$$
(1.4)
= $-10 \log T \left\{ 1 - \frac{|n_1 - 1|}{\pi \cdot n_1 \sqrt{2\Delta}} (\theta_1 + \theta_2) \right\}$

ただし,

T:光ファイバ端面間の光透過率.

$$\Delta = \frac{n_1^2 - n_2^2}{2n_1^2}$$
: 光ファイバの比屈折率差.

n₀:空気層の光屈折率≒1.

n₁:光ファイバ・コアの光屈折率.

n₂:光ファイバ・クラッドの光屈折率.

フェルールの斜め球面の傾斜角度 θ_1 が12度, θ_2 が-11.94度,光ファ イバ端面間の光透過率T=0.916, Δ =0.002,及び n_1 =1.47と仮定 して計算した挿入損失*IL*は約0.38 dBになる.一方,フェルールの斜 め球面の傾斜角度 θ_1 が8度, θ_2 が-7.96度,光ファイバ端面間の光透 過率T=0.925, Δ =0.002,及び n_1 =1.47と仮定して計算した挿入 損失*IL*は約0.34 dBになる.

5) 光ファイバ間のエアギャップによる光減衰量

エアギャップzが大きくなるに従って,光ファイバ1からの出射光の ビーム直径がエアギャップzの距離に比例して大きくなるので,光ファ イバ2に入射する光量は,その分だけ減衰して小さくなる.光ファイバ 1から出射する光束のパターンがガウス・ビーム (Gaussian beam) とし,光ファイバ端面が光軸に対して直角の場合,このエアギャップz によるシングルモ-ド光ファイバの光減衰量 IL_Aは式 (1.5) により与 えられる[12].

$$IL_{A}(dB) = -10\log T \left[\frac{1}{1 + \left(\lambda \cdot z/2\pi \cdot n_{0} \cdot \omega_{0}\right)^{2}} \right]$$
(1.5)

ただし,

λ:光の波長

 $n_o: 空気層の光屈折率 (= 1.0)$

ω。:光ファイバ端面におけるモードフィルド半径

ここで, APCコネクタのように, 光ファイバの端面が傾斜球面の場



図1.3 光ファイバ間のエァギャップによる光減衰量 IL_A

合は、この挿入損失は式(1.6)により計算できる[13].

$$IL_{A}(dB) = -10\log T \left\{ \left[\frac{1}{1 + (\lambda \cdot z/2\pi \cdot n_{0} \cdot \omega_{0})^{2}} \right] \cdot \exp \left[-\left(\frac{z \cdot \sin \theta_{0}}{\omega \sqrt{1 + (\lambda \cdot z/2\pi \cdot n_{0} \cdot \omega_{0})^{2}}} \right)^{2} \right] \right\}$$

$$(1.6)$$

ただし,

θ₀:光軸に対する光ファイバ1の光出射角度

図1.3は、光ファイバ端面の傾斜角度 θ が、各々0度、8度、及び12 度について、式(1.6)で計算した光ファイバ間のエァギャップzによる光減衰量 IL_A を示す。図1.3から、光ファイバ端面間距離が約100 µm の範囲において、光ファイバ端面の傾斜角度 θ が、各々0度、8度、及び12度おける光減衰量 IL_A は、光ファイバ端面間距離が1µmにつき、 各々0.04 dB、0.09 dB、及び0.14 dBになる.

光コネクタの挿入損失に影響する要因は,以上に述べたように多岐 にわたり,これらが複雑に相乗して最終的な挿入損失が決定される.特 に,光ファイバ端面間にエアギャップがある場合には挿入損失を低減で きないので,エアギャップを生成させない接続法は光コネクタにとって 重要な課題になる.

1.2.2 光コネクタの反射戻り光の要因

光ファイバの接続端面から光の入力側方向に反射される,反射戻り光 は,広帯域な画像信号のアナログ伝送,或いは超高速なデジタル信号の 伝送においては,光源であるレーザの雑音や歪を増加させる原因とな る.更に,閉ループ内で多くの接続箇所を有する光LAN(Local area optical network)においては,クロストーク(Crosstalk=漏話)の 原因となる[14],[15].従って,この反射戻り光は極力低減しなければ ならない.この反射戻り光の要因の概要を次に述べる.

1) 光ファイバ端面の光軸直角面に対する傾斜角度

図1.4 (a), (b)に光ファイバ端面の光軸直角面に対する傾斜角度と反 射戻り光の関係を示す.図1.4 (a)は、光ファイバ端面が光軸に対して 直角面の場合の反射戻り光について示す. P_o は伝送光量、 P_R は光ファ イバ端面からの反射戻り光量を示す.図1.4 (b)は、光ファイバ端面が 光軸直角面に対して θ だけ傾斜したときの反射戻り光について示す.図 1.4 (b)において θ_c は光ファイバ・コアを光が伝送できる最大角度であ る臨界角を示している.この臨界角 θ_c は式 (1.7)で表わされる[16].

$$\theta_c = \sin^{-1} \sqrt{2\Delta}$$

(1.7)

ここで,

$$\Delta = \frac{n_1^2 - n_2^2}{2n_1^2} \approx \frac{n_1 - n_2}{n_1}$$

フェルールの端面傾斜角度 θを,光ファイバコアの臨界角度 θ_cの2倍 以上にすることにより,光ファイバ端面で生じた殆どの反射戻り光 P_R は光ファイバ・クラッド層に放射吸収され,拡散して消滅するので,光 ファイバ・コアを光源に逆伝送される反射戻り光 P_Rを極限にまで小さ



図1.4 シングルモード光フアイバ端面の傾斜角度 θと反射戻り光 B_R

くできる.従って,この形式の光コネクタ・フェルールは,光ファイバ 端面の接続が開放された状態でも,反射戻り光は不変であると言う特徴 をもっている.図1.5から,光軸直角面に対するフェルール端面の傾斜 角度θを8度として,光波長λ=1.310 μmの場合,シングルモード光 フアイバの伝送光量に対する反射戻り光を-60 dB(0.0001%)以下に 低減できる.

式 (1.7) において, $\Delta = 0.002$, $n_o = 1.0$, 及び $n_I = 1.47$ と仮定 すれば, 臨界角 θ_c は約3.626度になる. 従って, シングルモード光ファ イバ付きAPCコネクタ・フェルールの端面傾斜角度 θ は, 一般に臨界 角の2倍以上の8度に設定されている. 次に, 反射戻り光 B_R は, 式 (1.8) で与えられる[17].

$$B_{R}(dB) = 10\log\frac{P_{R}}{P_{0}} = 10\log\left\{R_{0} \cdot \exp\left[-\left(\frac{2\pi \cdot n_{1} \cdot \omega \cdot \theta_{1}}{\lambda}\right)^{2}\right]\right\}$$
(1.8)

ただし,

$$R_0 = (n_1 - 1)^2 / (n_1 + 1)^2$$
$$V = 2\pi a n_1 \sqrt{2\Delta} / \lambda$$
$$n_2 - n_2$$

n

<第1章>



ここで,

 R_o : 光ファイバ端面の傾斜角度 $\theta_1 = 0$ 度における反射戻り光

n,:光ファイバ・コアの屈折率

n。: 光ファイバ・クラッドの屈折率

- ω: フェルール孔に固定された状態での光ファイバ・コアの室温(25°C)におけるモードフィルド半径
- λ: 光源波長

V: 規格化周波数

a: 光ファイバ・コア半径

∆: 比屈折率差

シングルモード光フアイバにおいて, $n_1 = 1.47$, $\omega = 4.1 \mu m$, $\lambda = 1.310 \mu m$ として, 光ファイバ端面の傾斜角度 θ_1 が0度から12度まで, 各々2度おきに変化した場合の反射戻り光 B_R の,式(1.8)により求 めた理論計算値を図1.5に示す.ここで,高橋の知見によれば,光ファ イバがフェルール孔にエポキシ接着剤で110~120°Cのキュアリング 温度でフェルールのマイクロ孔に固定された場合,キュアリング温度以



度以下の温度領域では,フェルールと光ファイバの線膨張係数の差異に よって,光ファイバ・コアに圧縮力が働く,従って,キュアリング温度 以下の温度領域では,光ファイバ・コアのモードフィルド半径ωは,自 由状態において測定されたカタログ値よりも縮小された数値を示す [18],[19].

2) 光ファイバ端面の面粗さ

光ファイバ端面の研磨面の粗さが大きい場合には,光ファイバ接続面 で伝送光の乱反射を生じて反射戻り光の増加の原因になる. 高橋らが 行った,フェルール端面を異なる粗さの研磨剤で光軸直角面に対して8 度の斜め球面研磨した場合の,光ファイバ端面からの反射戻り光の実測 値の例を図1.6 に示す.

1.3 光コネクタ技術の変遷

ここでは、光コネクタに対して要求される接続特性のうち、挿入損失 と反射戻り光に大きな影響を及ぼす光コネクタ・フェルールの先端の接 続面形状に関する従来技術の変遷について述べる.



光コネクタにより一対の光ファイバを接続した時に,一対の光ファイ バが全く同一のパラメータでできており,その接続面が完全に接触し, 光ファイバ間の光軸ずれがゼロ,かつ,曲がりなく接続されていれば, 1本の連続した光ファイバと同じであるから接続による光損失はゼロに なる.しかし,前述のように実際は多くの要因によりゼロにはならな い.

図1.7 (a)~(d) は、光コネクタの接続端面形状の変遷を示したもの である.初期の光コネクタ・フェルールの端面形状は、図1.5 (a) に示 すように、直角平面接続型フェルールを使用していた.すなわち、光軸 に対して直角面をもつフェルール端面を平面研磨することにより、光 ファイバ端面がフェルール端面から、数 µm程度の凹面に仕上げられて いた.従って、光ファイバは数 µmのエァギャップを介して接続される ことになるので、前述のように、光ファイバコアとエァ層との屈折率差 によるフレネル損失、光ファイバ端面間の多重損失による挿入損失、及 び光ファイバ端面間の距離による光減衰量を生じていた.従って、シン グルモード光ファイバの場合、光コネクタの挿入損失は0.7~2 dB程 度しか得られなかった[19].

同時に,光ファイバ端面から直角に反射される反射戻り光は約-14 dB程度しか得られなかった.従って,初期の光コネクタは,これらの 挿入損失及び反射戻り光などの接続特性において,大規模,かつ,高性 能の光ファイバ・ネットワークの構築には不適切であった.

図1.7 (b) は、以上の挿入損失及び反射戻り光などの接続特性を改善するために、光ファイバ端面間のエァギャップを除去することを目的 として、1985年に発表された直角球面接続型光コネクタ・フェルール の先端部を示す.この光ファイバ付きフェルールは、フェルールの先端 面を光軸に対して直角球面に成形研磨して仕上げられている.このフェ ルールの球面の中央部分の接点には、軸方向のコイルばね力が負荷さ れ、光ファイバを含むフェルールの球面の中央の微小な球面部分が円形 平面に弾性変形されて、光ファイバ端面間のエァギャップが除去され る.この形式の光コネクタは、PCコネクタ(Physical-contact optical connector)と呼称されて、現時点では、最も広く使用され ている光コネクタである[21].

光ファイバ端面が完全に密着した状態において、シングルモード光 ファイバ用FC/PCコネクタの平均挿入損失は 0.1~0.3 dB, 平均 反射戻り光は-48~-55 dBであり、これらの値は容易に得られる.た だし、何らかの原因で光ファイバ端面が完全に密着していない状態で接 続された場合、または、光ファイバ端面が接続されていない端面開放の 状態では、前述のフレネル損失その他の要因により、最低挿入損失は 0.32 dB以上に増加し、反射戻り光は約-14 dBに増加する.

図1.7(c)は、斜め平面接続型光コネクタ・フェルールの先端部を 示す.この形式の光コネクタ・フェルールの構想は、PCコネクタより 以前の1983年に発表されている[22].この形式の光コネクタは、前述 の事由によりフェルールの端面傾斜角度を、光ファイバコアの臨界角度 の2倍以上にすることにより、光ファイバ・コアを光源に逆伝送される 反射戻り光を極限にまで小さくできるようにしたものである.ただし、 欠点としては、研磨加工による量産時に、フェルール端面の傾斜平面の

角度の精度を厳密に一致させて研磨加工することは,工作技術的に至難 であった.このために,光ファイバ間のエァギャップを完全に除去する ことが出来なかった,従って,この形式のフェルールは実用された例は なく,単なる提案に終わっていた.

図1.7 (d) は、本論文の課題とする、斜め球面接続型光コネクタ・ フェルールの先端部を示したものである.これは、前述のPCコネクタ 及び斜め平面接続型光コネクタ・フェルールの欠点を改善したものであ る.すなわち、フェルールの端面傾斜角度 θを光ファイバコアの臨界角 度の2倍以上にすると共に、この傾斜面を球面に成形研磨したものであ る.従って、光ファイバ端面を開放した時でも、反射戻り光を-60 dB と無視できる大きさにできる.同時に、接続端面を斜め球面に成形研磨 することにより、フェルール端面の傾斜角度 θの加工精度を斜め平面接 続型光コネクタ・フェルールのように厳密に規制する必要がないと言う 特徴がある.この形式の光コネクタの提案としては、1985年に高橋に よって出願された特許の公開特許公報が1987年に開示されている [23].

斜め球面接続型光コネクタの実用化の実績としては、1986年に高橋 により製品化され、APCコネクタ(Angled-physical-contact optical connector)と命名されて、主としてUSA国内のCATV市場 に大量に供給された.

1.4 光ファイバ端面研磨技術の変遷

1.4.1 従来の研磨技術

光コネクタの組立工程で,最も重要な工程は,光ファイバをエポキシ 接着剤によりフェルールの中心孔に挿入して取付ける工程,及び組み立 てた光ファイバ付きフェルール端面を研磨加工する工程である.

前述の図1.7 (a)~(d)に示したように,光ファイバ通信システムの進 歩に伴って,光コネクタ・フェルールの端面の研磨形状は変遷してきた が,それに応じて,光ファイバ端面の研磨法も変遷してきた.図1.8及 び図1.9 にその実例の概要を示す.



の平面研磨法の概要

図1.8 (a),(b) は,初期の直角平面接続型光コネクタ・フェルールの 端面の平面研磨装置の上平面図,及び研磨軌跡の一例を示す.すなわ ち,初期の直角平面接続型光コネクタ・フェルールの端面の平面研磨 は,従来の金属などの顕微鏡試料用の平面研磨装置を,そのまま流用す るか,もしくは一部改造して使用されていた[24],[25].この場合,研 磨加工は図1.8 (a) に示すようにして行われていた.

第一の工程として, 白矢印方向に同軸回転する金属製の研磨盤D1の 面に研磨砥粒と研磨液を注いで, ホルダーH1に保持したフェルールの 先端面を研磨盤面に押し付けてフェルール先端面を平坦に研磨する. こ の場合, フェルール端面を通過する研磨砥粒の流れ方向は, 研磨盤の回 転方向と反対向きの黒矢印で示すように一定になる. このため, 図1.8 (b)に示すように, 一定方向に研磨傷が生じ易く, 一たん生じた研磨傷 は, 研磨の進行につれて成長拡大されて修復できない難点があった. 従って, このままでは, 光コネクタ用として使用できなかった. この研 磨傷の修復手段として, 第二の工程で, 回転円盤面にフェルト布などの 起毛材料を貼って構成したバフ研磨盤D1に, 二酸化セリウムの微粉末 と研磨液を注いでラッピングにより鏡面に仕上げていた. この場合, 硬



図1.9 従来の直角球面研磨装置の構造の概略

質のセラミック製のフェルールと軟質の石英ガラス製光ファイバの硬さ などの物性の差異により,柔らかい光ファイバ端面のみが研磨除去され るので,前述の図1.7 (a)に示したように,光ファイバ端面はフェルー ル端面から数 μmだけ 凹面に陥没した面に仕上げざるを得なかった.図 1.7 (a)に示した平面接続型光コネクタの光ファイバの凹みは,光ファ イバ研磨装置の技術不足によって生じたものであり,当時の研磨技術で はやむを得なかったと言える.

図1.8は、本論文による球面研磨装置が実用化される前に、市販され ていた唯一の直角球面接続型光コネクタ(PCコネクタ)・フェルール の端面の直角球面研磨装置の一例を示す[26].図1.8において、曲率 半径60 mmの球凹面に成形された研磨盤D2の凹面に研磨砥粒と研磨 液を注いで、白矢印で示す方向に研磨盤D2を同軸回転させる.一方、 ホルダーH2に保持されたフェルールの先端面を研磨盤面に押し付け、 ホルダーH2を黒矢印方向に揺動させる十字型の複合直線運動させる. これにより、フェルール端面は曲率半径60 mmの球面に成形研磨され る.この場合、フェルール端面を通過する研磨砥粒の流れ方向は、図1.7 (b)に示したと同様な十字形の研磨軌跡になる.従って、前述の理由に より、いったん生じた研磨傷は修復できないと言う欠点があった.更

に、PCコネクタには光ファイバ端面の凹みは許容されないので,前述の図1.7に記述したような,バフ研磨盤によるラッピングにより,研磨傷を修復する方法は採用できなかった.従って,光ファイバ端面の研磨品質,及び生産性の2点で,従来のPCコネクタの量産用研磨装置には解決すべき課題があった.

従って,本論文の主題であるAPCコネクタの実用化の前提として, 十分な研磨品質,及び生産性を具備した光ファイバ端面の斜め球面成形 研磨装置が必要であった.

1.4.2 公知の鏡面研磨法

図1.10(a),(b)は、本論文の斜め球面成形研磨装置の特徴を明らか にするために、従来のシリコン・ウエーハや、機械部品などの平面の鏡 面加工装置として使用されてきた、ラッピング盤の鏡面研磨原理の一例 の説明図を示す.図1.10(a)は、ラッピング盤の研磨メカニズムを示 す.研磨盤(Polishing plate)は回転軸(Rotation axis)を中心にし て矢印方向に回転させる.研磨盤面には、研磨剤スラリーが供給される. 研磨盤の上面には、加工物(Work)を保持孔(Guide hole)に挿入して保 持する円筒形の加工物ホルダ(Work holder)が配置されている.加工 物ホルダは2個のガイドローラ(2-Guide rollers)に回転可能に位置 決め保持される.加工物ホルダの保持孔は、加工物の形状に応じて任意 の形状とすることができる[27].

この状態で研磨盤を左回りに回転させると,研磨盤の中心側の周速度 V_1 よりも,外縁側の周速度 V_2 が大きいために,加工物ホルダは,この 周速度 V_1 と V_2 の差により自動的に矢印方向に左回りに回転することに なる.従って,加工物ホルダの保持孔に挿入された加工物も,同時に, 加工物ホルダと同じ回転速度で回転されることになる.

この場合,加工物の研磨面を通過する研磨剤の流れ方向の研磨軌跡 は,図1.10(b)に示すように,加工物ホルダの1回転につき,360度の あらゆる方向に変化することになる.従って,ある方向で,いったん研 磨傷が生じても,連続して変化する研磨軌跡により,研磨傷は自動的に



abrasives.

図1.10 ラッピング盤の研磨メカニズムとその研磨軌跡

修復される.これと共に,次第に研磨傷の微細化が進行して最終的に加 工面は鏡面にできる.

本方式のラッピング盤は、加工物自体を自転させて加工する原理に よっている.ただし、光ファイバ付きフェルールを本方式の加工原理に よって加工した場合には、光ファイバが捻られて切断されるので使用で きない.

1.5 A P C コネクタの研究課題

APCコネクタの研究課題として,まず,APCコネクタの製造の前 提となる,フェルール接続端面の斜め球面成形研磨法及び装置が挙げら れる.次に,APCコネクタの接続性能に重要な影響を与えるエア ギャップを極力規制するために,APCコネクタの構成部品,及び構造 がAPCコネクタの接続特性に与える影響についての理論解析が挙げら れる.

1.5.1 斜め球面成形研磨法及び装置の所要特性

フェルール接続端面の斜め球面成形研磨法に関しては,要求される機

械特性及び光学特性から次の前提条件が要求される.

1) 所要の斜め球面の曲率半径に成形研磨できること

第3章以降に述べるが、APCコネクタの場合、フェルールの斜め球 面の曲率半径の寸法、及びそのばらつきは接続特性に大きく影響する. 従って、そのばらつき範囲は狭いほど良いが、生産技術、経済性の制約 から、フェルールの斜め球面の傾斜角度が8度のAPCコネクタについ ては、一般に斜め球面の曲率半径の許容範囲は5 mm~12.5 mm程 度が目標になる.

2) 斜め球面の頂点の光軸に対する偏心が少ないこと

第3章以降に述べるが,APCコネクタの場合,斜め球面研磨球面頂 点が光軸に対して偏心すると,接続時の斜め球面接点の光軸からの偏心 を増加させる要因になる.従って,斜め球面の頂点の光軸に対する偏心 は零に近い値が目標になる.

3) 光ファイバ端面の凹みが小さいこと

前述のように、APCコネクタに限らず、どの形式の光コネクタについて言えることであるが、光ファイバ端面の凹みが大きい場合には、光ファイバ端面間のエァギャップを消去できなくなるので重要である.光ファイバ端面の凹みの許容範囲は、一般には0.05 µm以下に規定されている.ただし、本論文の第2章に述べるが、光ファイバ端面の凹みの許容範囲は斜め球面の曲率半径に依存する.

4) 光ファイバの端面の研磨傷が自動的に修復できること

前述のように,光ファイバの端面の研磨傷は,光コネクタの反射戻り 光の特性に影響するので重要である.従って,光ファイバの端面の研磨 傷が自動的に修復できる斜め球面成形研磨装置の研磨原理の新たな考案 を要する.

5) 高い生産性,及び経済性を具備していること

APCコネクタの大量生産を前提とした場合,生産性,経済性の視点から,高い生産性,熟練を必要としない容易な操作性,簡単な保守管理

性,低廉な消耗材料費,及び小型軽量であることを考慮しなければなら ない.

1.5.2 APCコネクタ

1) 接続時のフェルール回転

APCコネクタが、フェルールが回転した状態で接続された場合、こ のフェルールの回転角度は、APCコネクタの接続特性に非常に大きな 影響を及ぼす.すなわち、現在、最も広く普及しているFC及びSCコ ネクタの構造に見られるように、フェルールはプラグ・ハウジング内で コイルばねで浮動保持されており、接続時の円周方向の位置決め整列 は、複数のキー及びキー溝の嵌合により行われている.従って、これら の隙間はゼロにはできない.FCコネクタを接続した場合、フェルール 間の円周方向回転誤差は、これらの累積隙間により、計算では最大で16 度に達する[4].

PCコネクタの接続の場合は、このフェルール間の円周方向回転誤差 が接続特性に及ぼす影響は無視できる.しかし、APCコネクタでは、 接続状態によりフェルールが相互に回転することがあり、この時には各 フェルールの斜め球面はV字形状に開くので、フェルールの回転角に対 応したエァギャップが加算される.

1) APCコネクタの構成部品,及び構造

APCコネクタに組み込むフェルールは,前述のように,フェルール の接続端面が斜め球面に成形研磨されている.従って,PCコネクタの 組み込むフェルールとは端面形状が異なっているので,APCコネクタ の構成部品,及び構造を使用して,そのままAPCコネクタを構成して も良好な結果は得られない.従って,APCコネクタの接続特性を阻害 しないAPCコネクタの構成部品,及び構造を新たに研究することが必 要であった.

APCコネクタの課題としては,以上の斜め球面研磨装置の研磨特性,及び光コネクタの形状特性,寸法仕様などの総合された結果が,A PCコネクタの最終の接続特性に反映されるので.これらの解析が重要

である. しかしながら, これらに関する論文, 或いは特許は, ほとんど 高橋によるものであった[28]~[45].

1.6 本研究の目的と構成

本研究の目的は, APC光コネクタの生産に必要な, 光ファイバ端面の斜め球面研磨装置に関する研究, 及びAPCコネクタの挿入損失の改善に関する研究に関する.

第1章では,まず,光コネクタの接続損失に影響する要因,光コネク タ技術の変遷,及び光ファイバ端面研磨技術の変遷について記述した. 次いで,本研究の対象とするAPCコネクタに関する課題として,斜め 球面成形研磨装置の具備すべき要件,及び接続特性に影響する球面研磨 装置の研磨特性,並びにAPCコネクタの構成上の問題点について列挙 した.これらの研究の背景にもとずき,本研究の目的および内容につい て記述した.

第2章では,公転と自転の複合円軌跡運動をする弾性研磨盤に,固定 保持した光ファイバ付きフェルールを押し付けて行う,新しい考え方に よる光ファイバ端面の斜め球面成形研磨法及び研磨装置,及び本装置の 研磨特性について記述する.

第3章では,テ-パ・フェルール付きAPCコネクタについて,その 形状特性及び接続特性の理論解析を行い,APCコネクタに関する普遍 的な課題について記述する.

第4章では,第3章で記述したテーパ・フェルール付きAPCコネク タについて,フェルール回転角度φ≧0度の条件における接続特性を理 論解析して明らかにする.

第5章では,第3章,及び第4章で明らかにした,テ-パ・フェルー ル付きAPCコネクタの課題を解決するために,新たに提案したステッ プ・フェルール付きAPCコネクタについて,フェルール回転角度 φ≧ 0度の条件における形状特性,及び接続特性の理論解析を行い,更に, 接続特性を改善するために,APCコネクタの構成部品の設計仕様の改 善提案に関して記述する.

第6章では、テーパ・フェルール付きAPCコネクタと、ステップ・ フェルール付きAPCコネクタについて、フェルール回転角度 φ≧0度 の条件における接続特性の比較評価実験を行い、第3章から第5章に述 べた理論解析値と実験データを比較して考察する.

第7章では、本研究結果の内容を取りまとめると共に、本研究による 斜め球面成形研磨装置の実用実績と応用についての概要を記述する.次 に、本研究により実用化したステップ・フェルール付きAPCコネクタ に関して実用実績、及びステップ・フェルールのIEC国際規格への採 用について概要を述べる.

第1章参考文献

- [1] 大久保勝彦, "ISDN時代の光ファイバ技術," 利理工学社, pp. 1-5, 1989.
- [2] "技術指導資料: FC Type Fiber Optic Connector 図面," NTT アドバンステクノロジー株式会社, 1986.
- [3] International Electrotechnical Commission, "INTERNATIONAL STANDARD IEC-874-2, Part 2: Sectional specification for fibre optic connector - Type F -SMA," 1993.
- [4] "技術指導資料: FA Type Fiber Optic Connector 図面," NTT アドバンステクノロジー株式会社, 1986.
- [5] "技術指導資料: SC Type Fiber Optic Connector 図面," NTT アドバンステクノロジー株式会社, 1989.
- [6] "技術指導資料: MU Type Fiber Optic Connector 図面," NTT アドバンステクノロジー株式会社, 1994.
- [7] "技術指導資料: MT 型光ファイバコネクタの設計・組立技術,"NTT アドバンステクノロジー株式会社, 1992.
- [8] D. Marcuse, "Loss Analysis of Single-Mode Fiber Splices," Bell System Tech' Journal, Vol. 56, No. 5, p. 714, 1977.
- [9] New-Port Catalogue, New-Port Co., LTD. pp. J-23, 1990.
- [10] 鈴木,他, "光コネクタ損失特性の端面処理効果,"昭56年度信学 全大, No. 2256, 1981.
- [11] 土屋,中込,清水, "二重偏心コネクタの損失特性," 信学光量 IV 研資, OQE75-52, 1975.
- [12] D. Marcuse, "Loss Analysis of Single-Mode Fiber Splices," Bell System Tech' Journal, Vol. 56, No. 5, p. 713, 1977.
- [13] M. Takahashi, "Variable Light Attenuator of Improved Air-gap Type with Extremely Low Returning Light," Proc, IEEE IMTC/94, Vol. 2, pp. 947-950, (May. 1994).
- [14] O. Hirota, et al., " Properties of intensity noises of laser Diodes Due to reflected

waves from single-mode optical fibers and its reduction," IEEE, Quantum Electron, vol, QE-17, P. 1014,1980.

- [15] M. M. Choy, et al., " Interferrometric conversion of laser phase noise by single mode fiber-optic components," Electron, Lett, vol. 23, p. 115, 1987.
- [16] "最近の光伝送入門,"NTTアドバンスドテクノロジ株式会社, 1991.
- [17] A. Benner, et al, "Low-reflectivity in-line variable attenuator utilizing optical fiber taper," IEEE J. Lightwave Technology, Vol. 8, pp. 703-718, 1977.
- [18] M. Takahashi, "Generating Mechanism of Maintaining Force for Optical Fiber Installed in Ferrule Hole," IEEE Journal of Lightwave Technology. (Accepted subject to minor revision, October, 1997. Assigned No, 3250).
- [19] 高橋光雄, "光コネクタの温度特性に及ぼす要因の一考察," 電子 情報通信学会. Vol. R95-45, pp. 57-62. (02, 1996)
- [20] N. Suzuki, "Design And Fabrication Of High Performance Optical Connectors," IEEE, GLOBECOM' 83, pp. 1196-1200, 1983.
- [21] E. Sugita, et al, "Highly Stable Physical Contact Optical Fiber Connector with Convex End," IEEE J. Lightwave Technology, Vol. 11, pp. 241-248, Feb., 1993.
- [22] 鈴木信夫.他, "光コネクタ損失特性の端面処理効果," 昭56年度 信学全大, No.2256, 1981.
- [23] 高橋光雄, "光コネクタ組立体およびその研磨治具並びに光ファイバの接続方法,"公開特許公報 平1-121805, (1987)
- [24] T. Masuko, et al., "Polishing Machine For Ferrule Of Optical Fiber Connector," US Patent. No. 4,839,993. 1989.
- [25] カタログ, AT. NO. FP6-5NO:端面研磨機 OFL-2, セイコー電子 工業株式会社. 1985.
- [26] カタログ, AT. NO. FP6-5NO:端面研磨機OFL-601,セイコー電子工業株式会社. 1987.
- [27] 結城一郎, "ラッピング装置, 特許公報,"昭 39-10298, 1964.
- [28] M. Takahashi, "Elastic Polishing Plate Method and Conditions for Forming Angled Convex Surface on Ferrule Endface," IEEE Journal of Lightwave Tech-

nology. Vol. 15, No. 9, pp. 1675 - 1680, Septenber, 1997.

- [29] M. Takahashi, "Optical Fiber end-surface Polishing Device", US Patent. No. 4,979,334. 1990.
- [30] M. Takahashi, "Method and Apparatus for Grinding Foremost End Surface of a ferrule," US Patent. No. 5,216,846. 1993.
- [31] M. Takahashi.: "Method for Grinding Ferrules For Ribbon Type Optical Connectors", US Patent. No. 5,265,381. 1993.
- [32] M. Takahashi.: "Apparatus For Grinding Endfaces of Ferrules Together with Optical Fibers Each Firmly Received in Ferrule", US Patent. No. 5,351,445. Oct 4, 1994.
- [33] M. Takahashi, "Optical Fiber End-Surface Polishing Device," US Patent. No. 5,547,418. 1996.
- [34] M. Takahashi, "Optical Fiber Ferrule Holding Plate for Optical Fiber End Polishing Apparatus," US Patent. No. 5,640,475. 1997.
- [35] M. Takahashi, "Compatibility of Conventional-Ferrule with Step-Ferrule for Angled Convex Optical Connectors," Proc. 45th IEEE ECTC, pp. 406-412, (May, 1995)
- [36] M. Takahashi, "Novel Stepped ferrule for angled convex polished optical fiber connector," Proc. IEEE OFC'95. San Diego, Vol. 8, pp. 184-185, (Feb, 1995)
- [37] M. Takahashi, "Compatibility for optical connectors with different slanted angles at their ferrule endfaces," Proc. IEEE CLEO / Pacific Rim'95. pp. 304. (July, 1995)
- [38] 高橋光雄, "斜め球面研磨光コネクタの接続端面角度差異による互換性"日本電子部品信頼性センタ、RCJ 第4回電子デバイスの信頼性シンポジューム、pp. 39 45, (11, 1995)
- [39] M. Takahashi, "Experimental Considerations for APC Optical Connectors with Slanted Angle of 8 degrees," Reports of The Graduate School of Electronic Science and Technology of Shizuoka Univ., Vol. 17, pp.89-95. 1996.
- [40] M. Takahashi, "Optical Fiber Connector", US Patent. No. 4,747,659. 1989.

- [41] M. Takahashi, "Optical Fiber Connecting Device," US Patent. No. 4,953,941.1990.
- [42] M. Takahashi, "Optical Connector Ferrule", US Patent. No. 5,140,660.1992.
- [43] 杉田悦治,他, "斜めPC(APC)コネクタの互換性試験結果," 1995 信学春全大, C-289. 1995.
- [44] 平 淳司,他, "超低反射戻り光Angled-PCコネクタ," 1994信 学春全大, C-204. 1994.
- [45] 皆見浩二,他, "斜めPC (APC)コネクタの端面成形法," 1996 信 学春全大, B-991. 1996.
第2章 斜め球面研磨法及び研磨装置、並びに研磨特性

2.1 まえがき

本論文の研究課題であるAPCコネクタの量産実用化のためには,第 1章で述べたように,好適な性能を有する斜め球面成形研磨装置が前提 となっていた.そこで,固定保持した光ファイバ付きフェルール端面 を,公転及び自転の複合円運動をする弾性研磨盤に押し付けて行う研磨 機構による斜め球面成形研磨装置が,1989年に高橋により新たに開発 実用化されて,それが市場に提供されて,APCコネクタの量産が可能 となった.

第2章では、初めに、フェルール端面の公転研磨軌跡と弾性研磨盤を 併用した斜め球面成形研磨の原理について述べる.次に、量産を対象と して製作した、12軸同時研磨用の斜め球面成形研磨装置の構成につい て述べる.さらに、本斜め球面研磨装置の量産上の実用性について記述 する.ここで記述する実用性データは、本球面成形研磨装置を使用し、 シングルモード光フアイバ用として、APCコネクタフェルールを8度 に斜め球面成形研磨する実験により得られたものである.

2.2 球面成形研磨法の理論

2.3 項では、本論文の斜め球面成形研磨装置を構成するために、新たに提案した球面成形研磨法の理論について述べる.

2.2.1 研磨軌跡

1) 鏡面ラッピングの研磨原理

光コネクタの光学特性を満足させるために,光ファイバ端面は鏡面に 仕上げなければならない.第1章で述べたように,シリコン・ウエ-ハ や,機械部品などの平面の鏡面加工装置としては,ラッピング盤が使用 されていることは公知である.ラッピング盤の加工は,加工面を通過す る研磨剤の流れ方向が,常に変化するようにしたものであり,このとき の研磨軌跡により,研磨過程において,ある一方向で研磨傷がついて も,次の研磨軌跡で自動的に修復させることができる.本論文の研磨装



置は、このようなラッピング盤の研磨原理により実現している[1],[2].

しかし,従来から公知のラッピング盤は,加工物自体を自転させて加 工する原理によっている.従って,光ファイバ付きフェルールを本方式 の加工原理によって加工した場合には,光ファイバが捻られて切断され るので使用できない.

本論文に述べる斜め球面成形研磨装置は,光ファイバ付きフェルール を固定保持した状態で,研磨盤を公転させて得られる研磨軌跡により, 従来のラッピング盤と同一の研磨軌跡を得るように構成したことに特徴 がある.

2) 偏心盤による公転機構

図2.1 (a), (b) は, 新たに提案する研磨盤の公転機構を説明した図で ある.前述のように, 光ファイバ付きフェルールの端面の斜め球面の成 形研磨では, 光ファイバ付きフェルール自体を回転して研磨を行うこと はできない.そこで, 図2.1 (a) に示すように, 固定されたホルダ・プ レート(Holder plate)中心〇から半径 r_0 上に, 3 個の回転偏心盤(3-Eccentric rotation plates)を,等角度,かつ,回転可能に取付け, 研磨盤の公転駆動機構を構成する.各回転偏心盤は,中心の回転軸から

半径 r_1 上に,各々偏心ロッド(3-eccentric rods)を取付けて構成す る.一方,研磨盤(Polishing plate)を取付けたターンテーブル(Turntable)の裏面には、中心から半径 r_0 上に、3個の軸受孔(3bearing holes)を等角度に設けてある.公転機構は、ターンテーブル の裏面の3個の軸受孔に、3個の偏心ロッドを挿入して組み立てて構成 する.

この場合,3個の偏心ロッドの位置関係は,ターンテーブルの裏面の 3個の軸受孔に拘束されるので,ターンテーブル自体が結合リンクにな る.従って,3個の回転偏心盤のうちの1個を回転駆動すれば,他の2 個の3個の回転偏心盤は連動して,同期回転できる.ここで,ターンテー ブルは,ターンテーブルの中心Pとホルダ・プレートの中心点Oとを結 ぶ線分を公転半径r,として,公転運動をする.

2) 偏心盤方式による研磨盤の研磨軌跡

図2.2 (a), (b), (c), (d) は, 図2.1 で述べた偏心盤方式による研磨盤 について,公転運動の角度による研磨盤の位置関係を説明した図であ る.図2.2 (a)では,ターンテーブルの公転運動の角度が白矢印Aの示 す位置関係を零度とする.ターンテーブル外縁の記号Kは,ターンテー ブルの角度位相を示す.いま,3個の回転偏心盤の1個を右回りに駆動 すれば,ターンテーブルは,K点の位置方向を保ったまま,公転半径r₁ で右上方向に移動する.図2.2 (b)は,白矢印Bの示すように,回転偏 心盤が90度回転した状態を示す.同様に,図2.2 (c),(d)は,白矢印 C及びDの示すように,回転偏心盤が,各々180度,270度回転した 時のターンテーブルの位置関係を示す.図2.2 (a)~(d) に図示したよ うに,ターンテーブルの位相点Kの方向が一定のまま,ターンテーブル は1回公転する.

3) 公転による研磨軌跡

図2.3 (a), (b) は,フェルールが研磨盤面の任意の点に位置している 場合に,研磨盤の公転により,フェルール先端面を通過する研磨砥粒の 流れ方向(=研磨方向)が変化する状態を示す.図2.3 (a)においては,



(c). Orbital motion = 180 degrees.
(d). Orbital motion = 270 degrees.
図 2.2 公転運動の角度による研磨盤の位置の説明図

ターンテーブルに載せた研磨盤は,黒矢印で示すように右回り方向に公転させているものとする.このとき,図2.2(a),(b),(c),(d)に記した公転位置A,B,C及びDの各方向に対応するフェルールの位置を各々A',B',C'及びD'とすれば,各々の位置における研磨方向は,公転方向と逆方向の直線の黒矢印で表わされる.これらの研磨方向は,研磨盤の1公転毎に360度のあらゆる方向に連続して変化する.同時に,研磨速度はフェルール端面の全面にわたって一様になる.従って,鏡面仕上げ研磨工程において,仮に,ある研磨方向で光ファイバ面に研磨すり



傷が発生しても,連続して変化する研磨方向により,この研磨すり傷は 自動的に修復できる.従って,光ファイバ端面は光学的に優れた研磨面 に仕上げられる.このように,被加工物を回転しないように,固定保持 して鏡面仕上げを行う研磨機構は,他の特許,文献には公表されていな かった特徴である[3]-[5].

2.2.2 研磨盤の公転及び自転の複合運動機構

研磨盤の運動が公転のみの場合には,光ファイバ付きフェルール端面 は,研磨盤面の一定の位置で連続して研磨が繰り返されることになる. 従って,研磨盤は,公転しながら円周方向に自転させる必要がある.公 転による円軌跡の楕円化を極力少なくするために,自転の角速度は,公 転の角速度に比較して十分に遅くしなければならない.例えば,1:50 ~1:100程度に十分に遅くしなければならない.従って,自転機構の 回転数の減速比は大きくしなければならない.

図2.4は,前述の図2.2の公転機構に自転機構を付加して,研磨盤の 公転及び自転の複合円運動を行わせる機構を説明した図である.本論文



Drive pinion gear

図2.4 公転及び自転の複合円運動を行なう研磨盤の駆動機構

に記述する研磨盤の自転機構には、3 個の回転偏心盤を取付けるホル ダ・プレートの外周に大径の歯車を形成して、小径の駆動ピニオン歯車 を噛み合わせる簡単な駆動機構を採用した.その他、自転の駆動機構と しては、タイミング・ベルトによる方式、ハーモニック歯車機構などの 方式を考えたが、いずれも、機械的な耐久性、保守性が懸念さたので採 用しなかった[6].

公転及び自転による複合円運動により,研磨した場合の研磨軌跡を図 2.5 に示す.図2.5 において,Oは,ターンテーブルの中心Pの公転円 の中心である.Fはフェルールであり,ターンテーブルの中心Pから距 離Sの位置に固定されているものとする.ここで,ターンテーブルの公 転方向を,黒矢印で示すように右回りとし,白矢印で示す自転方向を左 回りにすれば,フェルールFは,公転半径 r_1 で右回りに公転する.この 公転円軌跡を L_1 とし,また,公転円軌跡 L_1 の中心を P_F とすれば,フェ ルールFの公転軌跡 L_1 の中心 P_F のターンテーブルの中心点Pからの自 転半径 r_2 は(S+ r_1)になる.従って,フェルールFの公転軌跡 L_1 の 中心 P_F は,ターンテーブルの自転に連動して右回りに移動するので,



図 2.5 公転及び自転の複合円運動を行なう研磨盤による フェルール端面の研磨軌跡

フェルールFの複合円運動による研磨軌跡Lは $(L_1 + L_2)$ で表わされる.

2.2.3 研磨領域とフェルールの配置

前述のように、光ファイバ付きフェルールの研磨加工には、面積の大 きく取れる平板状の研磨盤を使用している.平板状の研磨盤では、多数 個の研磨加工が同時にできる利点がある.図2.6に、公転及び自転の複 合円運動をする研磨盤の研磨領域と、フェルールの配置例を示す.前述 の図2.5から、研磨領域の最大直径は、(2S + 4r₁)になる.また、最 小直径は、(2S)になる.従って、フェルールFが常にこの研磨領域の 内部になるように、フェルールFを配置しなければならない.ここで、 この研磨領域条件を満たす研磨ホルダの直径 ϕ Dは、図2.6から、(2S + 2r₁)になる.この研磨ホルダの直径 ϕ Dの円周上に、複数個のフェ ルールを配置することができる.

2.3 弾性研磨盤による斜め球面成形研磨

2.2 項で述べたように、本論文の斜め球面成形研磨装置においては、 弾性材質板の上面に研磨フィルムを貼付した弾性研磨盤を使用して,球



図 2.6 公転及び自転の複合円運動をする研磨盤の研磨領域 とフェルールの配置例

面成形を実施する.

2.3.1 弾性研磨盤による斜め球面成形研磨法

図 2.7 (a),(b),(c) 及び(d) は,弾性研磨盤による球面成形研磨の 原理を説明した図である.弾性研磨盤は,ネオプレン合成ゴム平板の上 面に,研磨フィルムを貼付して構成する.図2.7 (a)には,予め,先端 面を所定の角度 θに,斜め平面研磨したフェルールの形状を示す.この 斜め平面研磨は,ガラス製平板の上に研磨フィルムを貼付した平面研磨 盤により行う.

図2.7(b)は、フェルールの先端部が、研磨ホルダの下面から一部 分突出するようにホルダプレートに取り付けて、研磨荷重W(=Σw) を負荷した状態を示す.このとき、フェルール下面と弾性研磨盤面の 接触面とに負荷される分布荷重wの大部分は、フェルールの外縁部に集 中する[7].この状態で弾性研磨盤を公転円運動させると、最初にフェ ルール先端面の外周縁部付近のみが中空同心円状に研磨除去される.研 磨の進行に伴って、図2.7(c)に示すように、ドーナツ状の研磨除去面 積は次第に増加し、フェルール下面と弾性研磨盤面の接触面とに負荷さ



図2.7 弾性研磨盤による斜め球面成形研磨の研磨原理の説明図

れる分布荷重wは次第に減じてくる.最終的に,研磨除去面がフェルー ル中心に達した時点で,フェルール下面と弾性研磨盤面の接触面とに負 荷される分布荷重wは,図2.7(d)の小矢印に示すように,全面が均 ーになる.その結果,フェルール端面の研磨除去量は外縁部程多く,中 心に接近する程減じてくるので,最終的に,図2.8(d)に示すように フェルール端面を球面状に成形することができる.

2.3.2 研磨フィルム及び研磨液

予備平面研磨及び球面成形用には、粒度が15~20μmのSiC 砥粒 を結合した研磨フィルムを使用できる. 粗研磨用には、粒度が6~9μ mのダイアモンド砥粒、中研磨用には粒度が1μmのダイアモンド砥 粒を結合した研磨フィルムを使用できる. 仕上げ研磨には、粒度が0.3 μm以下の超微粒子のSiO₂砥粒 (ゾル)をポリエステル・フィルムに 塗付したラッピング・フィルムを使用して好結果が得られる. 研磨液 は、蒸留水を研磨フィルム面に乾燥しない程度に少量散布する.

各工程の標準研磨時間は,使用するフェルールの寸法形状によって若 干異なるが,予備平面研磨及び球面成形に各30~40秒,粗研磨,中研 磨,及び仕上げ研磨には,各々30秒程度が必要である.

2.4 斜め球面成形研磨装置

2.4.1 斜め球面成形研磨装置の構成と研磨軌跡

図2.8 (a),(b)に,前述の球面成形研磨理論を基本として構成した, 量産用の12軸斜め球面成形研磨装置の構成及び駆動機構を示す.図 2.8 (a)は上平面図,図2.8 (b)は側断面図を各々示す.図2.8 (a)にお いては,直径が125 mm,厚さが5 mmのネオプレン合成ゴム製弾性 円盤の上面に,研磨フィルムの中心部分を両面接着テープ片で貼付して 構成した弾性研磨盤を,ターンテーブルに載せて研磨盤(Polishing plate)を構成する.本弾性研磨盤は各研磨工程毎に1枚ずつ準備してお く.これにより,各研磨工程毎にワンタッチで弾性研磨盤を交換でき る.弾性研磨盤の代わりに,ガラス円盤に研磨フィルムを貼付した硬質 研磨盤を使用して,フェルール端面の平面研磨に使用することもでき る.

研磨プレートの中心点 P は、O 点を公転の中心軸とした半径 r_1 (= OP = 15 mm) 上におく、そこで、研磨プレートを高速(140 rpm)

で公転させると同時に微低速(1.4 rpm)で自転させる.一方,12個 の光ファイバ付きフェルールFを,ホルダー・プレート(Holder plate) に設けてあるアダプタの傾斜角度8度の取付け孔に挿入して固定する. この際,研磨代としてフェルール先端部は,0.1~0.2 mmだけホル ダープレート下面と研磨フィルム上面間隙間(=0.2 mm)より多く突 出するように設定しておく.ホルダー・プレートは,4隅のステイロッ ド(Stay-rod)に載せてから,4個の水平回転できるセットレバ-(Setlever)を内側に回して取付ける.ステイロッドには,各々圧縮力調節可 能に圧縮ばねが内臓されている.よって,セットレバーに設けたプレス ピン(Press pin)により,ホルダー・プレートに研磨荷重を付加できる.

このようにして、O点を公転軸として、研磨プレートを半径 r_1 で右回りに高速公転させ、同時に、微低速で左回りに自転させる.これにより、 L_1 で示す公転半径 r_1 (=15 mm)の公転軌跡の中心が、 L_2 で示す自転半径 r_2 (=44 mm)に沿って移動する.これらの円運動によって図2.8 (a)に示すような複合連続円軌跡 L_1+L_2 が得られる.

2.4.2 研磨盤の駆動機構

図2.8 (b)は、球面成形研磨装置の駆動機構を示す.動力部は、一対 の公転用減速電動機及び自転用減速電動機により構成する.ここで、公 転用減速電動機1 (Geared motor 1)は、先端部に駆動ピニオン歯車 1 (Drive pinion gear 1)を備え、自転用減速電動機2 (Geared motor 2)は、先端部に駆動ピニオン歯車2 (Drive pinion gear 2)を備 えたものである.

ターンテーブルの公転の駆動機構は次のようにして構成する.

1) 大径の外歯車円盤(External geared disk)

外歯車円盤の同一半径上には、3等配に配設した3本の軸受け孔を設けてある.

2) 3個の偏心盤(Eccentric rotation disk)

各偏心盤には、円盤の中心から半径r₁の位置に、各々偏心ロッド (Eccentric rod)を設けてあると共に、各偏心盤の中心には回転軸を取





付け、このうちの1本の軸には、前記の駆動ピニオン歯車1と噛み合う 被駆動歯車(Driven gear)を取付けて1個の偏心盤を回転駆動するよう にし、他の2個の偏心盤の回転軸は、自由に従動回転するようにする.

3) 歯車組立

外歯車円盤の同一半径上に、3等配に配設した3本の軸受け孔に、3 個の偏心盤を挿入して構成した歯車組立.

4) ターンテーブル

ターンテーブルの裏面には,前記の3個の偏心盤に設けた3本の偏心 ロッドを挿入する3個のベアリング孔を設けてある.

以上のように、ターンテーブルの公転駆動機構を構成する.ターン テーブルの公転運動において、動力は、駆動ピニオン歯車1⇒1個の偏 心盤⇒3個の偏心盤の同期回転⇒3本の偏心ロッドの同期回転⇒ターン テーブル裏面の3個のベアリング孔⇒ターンテーブルの公転の順に伝達 される.

ターンテーブルの自転駆動機構は,駆動ピニオン歯車2を大径の外歯 車円盤に噛み合わせて構成する.ターンテーブルの自転においては,動 力は、駆動ピニオン歯車2⇒大径の外歯車円盤の順に伝達される.

この自転機構により,研磨フィルムの局部的な摩滅防止,及び研磨ス ラッジの排除によって,光ファイバ端面の研磨品質の安定化が図られ る.更に,この自転機構により,研磨フィルム面積を有効に使用できる.

図2.9は、図2.8で記述した12軸斜め球面成形研磨装置の構成部品, 及び組立構造の詳細図である.表2.2は部品名リストである.

2.4.3 斜め球面成形研磨装置の実施例

図 2.10 は、図 3 の機構に準拠した 12 軸斜め球面成形研磨装置の写 真を示す.この研磨装置は、12 個の光ファイバ付きコネクタの同時研 磨機能を備えたものである.本斜め球面成形研磨装置の寸法は、ファイ バ支柱を除いて、230(W)×230(D)×255(H) mm、質量は16 kgfで ある.電源は100~240V AC 電源を使用する.本研磨装置は、フェ



図 2.9 12 軸斜め球面成形研磨装置の組立部品及び構成図

No	Parts name	Q't y	No	Parts name	Q't y
1	Turntable	1	18	Control panal	1
2	Bearings	3	19	Fan guard	1
3	Thrust ring	1	20	Adjust washers	4
4	Alignment plate	1	21	Stay rods	4
5	Eccentric disks	3	22	Press rods	4
6	Bearings	3	23	Press pins	4
7	External geared disk	1	24	Coil springs	4
8	Driven gear	1	25	Hunger holder	1
9	Washers	2	26	Hunger rod	1
10	Snaprings	2	27	Beam holder	1
11	Baseframe	1	28	Beam	1
12	Drive pinion gear 2	1	29	Protect ball	1
13	Geared motor 2	1	30		
14	Drive pinion gear 1	1			
15	Geared motor 1	1			
16	Guide pins	8			
17	Base housing	1	-		

表 2.2 12 軸斜め球面成形研磨装置の部品名リスト

ルールのホルダープレート着脱時間,洗浄時間を含めて6~7分で12 個の光ファイバ先端を同時に斜め球面成形研磨できる(傾斜平面研磨を 含む).従って、毎時100~120個の斜め球面成形研磨能力を具備して いる.

図2.11に,野外組み立て用に,DC12Vで駆動できるようにした12 軸,6軸及び2軸の同時研磨用の斜め球面成形研磨装置の写真を示す. これらの球面研磨装置の仕様の概要として,ファイバ支柱を除いた寸法 は,150(W)×150(D)×165(H)mmから90(W)×120(D)×115(H) mmの範囲である.質量は,4.6 kgfから3.2 kgfであり,小型軽量 に構成してある.

2.5 斜め球面成形研磨装置の評価実験

2.5.1 評価実験項目と評価基準





図 2.10 工場生産用の 12 軸斜め球面成形研磨装置の 1 例の写真

図 2.11 野外組立用の 12 軸, 6 軸及び 2 軸斜め球面成形研磨 装置の 1 例の写真 <第2章>

1) 評価実験項目

図2.10の写真に示した12軸斜め球面成形研磨装置を用い,フェルー ル端面傾斜角度を8度に設定したシングルモード光ファイバ付きAPC 光コネクタ・フェルールについて,斜め球面成形研磨に関する性能評価 実験を行った.一般に,斜め球面成形研磨装置の性能評価は,球面曲率 半径のばらつき,光ファイバ光軸からの球面頂点の偏心,光ファイバ端 面のフェルール端面からの凹み量などの機械特性,及び挿入損失,反射 戻り光などの光学特性について行われている.

ここで,単心光ファイバ用APCコネクタの対象になるフェルールの 代表的な直径は,FC型及びSC型コネクタ用の2.5 mm,及びMU型 コネクタ用の1.25 mm,さらに,高橋により考案されたステップ・フェ ルールの1.4 mmである[8]-[13].これらのフェルール端面の直径は, 各々2 mm,1 mmおよび1.4 mmであるので,評価実験には以上の 3種類のフェルールを使用した.

2) 評価基準の設定

性能評価は、シングルモード光ファイバ用8度FC/APCコネクタ の、一般市場取引きに適用される規格に準拠する.すなわち、機械特性 は、球面曲率半径が5~12.5 mm、斜め球面の傾斜が8度の計測基準 面に対して測定した,光ファイバ光軸からの斜め球面の頂点の偏心が 50 µm以下、光ファイバ端面のフェルール端面からの凹み量が-0.05 µm以内とした.光学特性の性能評価の基準としては、反射戻り光は-60 dB以下、挿入損失は0.5 dB以下とした.

3) 実験条件の設定

実験条件は次のように設定した.

3.1) フェルール

実験試料として,標準のFC形ジルコニア・セラミック製フェルール を使用した.フェルール先端部は,図2.12に示すように,直径が2 mm, 1.4 mm および1 mm,長さが0.5 mmの直円筒に加工した.フェ ルールの直円筒部外径の中心孔に対する偏心は5 µmT.I.R(=Total in-



(a). Ferrule endface diameter of 2.0 mm.



(b). Ferrule endface diameter of 1.4 mm.



(c). Ferrule endface diameter of 1.0 mm.
図 2.12 フェルール試料の形状

dicator reading = ダイアルインヂケータの読みの最大値と最小値の 差)に規制した.このフェルールにシングルモード光フアイバを接着し て,FC型光コネクタ・プラグに組み込んで実験試料とした.試料個数 は1種類について,12個を1ロットとして,5ロット(合計60個),3 種類で合計180個を製作した.

3.2) コネクタ部品

コネクタプラグ及び整列アダプタはFC型コネクタ用を使用した.た

<第2章>

だし,相互のフェルール間の円周方向の回転誤差を4度以下に規制した ものを使用した.

3.3) 研磨盤

最初の平面研磨用には、厚さ5 mmのガラス製円盤に研磨フィルム を貼付した研磨盤を使用した.球面研磨用には、厚さが5 mm、ショアー 硬さ(H_s)が各々70,80,及び90のネオプレン合成ゴム製円盤の上 面に、各々研磨フィルム貼付した3種類の硬さの弾性研磨盤を使用し た.ただし、研磨フィルムを貼付きした実装状態では、弾性研磨盤の研 磨フィルム上面で、硬さの実測値は各々 Hs = 80,90及び100 であっ た.

3.4) 研磨荷重

研磨荷重は,各研磨工程共通に各々100 grf/mm², 150 grf/mm² 及び200 grf/mm²の3種類に設定した.

3.5) 研磨フィルム及び研磨液

研磨フィルムは、予備平面研磨及び球面成形用には、粒度が15~20 μmのSiC 砥粒を使用した. 粗研磨用には粒度が6~9 μmのダイアモ ンド砥粒,中研磨用には粒度が1μmのダイアモンド砥粒を使用した. 仕 上げ研磨には、粒度が0.3 μm以下の超微粒子のSiO₂砥粒(ゾル)をポ リエステル・フィルムに塗付したラッピング・フィルムを使用した. 研 磨液は、蒸留水を研磨フィルム面に乾燥しない程度に少量散布する方法 で行った.

3.6) 研磨速度及び研磨時間

上記 12 軸斜め球面成形研磨装置では,研磨速度は約13 m/分である.各工程の標準研磨時間は,予備平面研磨及び球面成形に各30~40秒,粗研磨,中研磨,及び仕上げ研磨には,各々30秒の量産条件とした.

4) 測定装置

図 2.13(a), (b)は、本研磨実験で使用した測定装置の写真である.測



(a). View of measuring equipment.



(b). View of detecting portion.図 2.13 光干渉方式の光コネクタ端面測定装置

定は,光コネクタの表面からの反射光と,オプチカルフラットから反射 された参照光との間の干渉縞を測定する方法によっている[14].図 2.13(a)は,本測定装置の全体の構成を示す写真である.図2.13(b)は, 光コネクタの取付け部分の拡大写真である. <第2章>

2.5.2. 評価実験結果

1) 研磨軌跡と研磨形状

図2.14に、フェルール先端の研磨軌跡例の写真を示す.この研磨軌跡は、研磨フィルム上でトレースされたものである.図2.14から、本研究の意図した公転及び自転による複合円研磨軌跡が明瞭に具現されていることが判る.

図2.15(a)は、光干渉測定器で測定したフェルール端面の干渉編の 写真を示す.図2.15(a)では、フェルールの先端部直径が1.4 mmの 場合を示している.図2.15(a)から、研磨面は同心円状の球面に成形 されていることが判る.本研磨装置の公転及び自転の運動軌跡から計算 すると、端面傾斜角度8度に起因する球面の楕円は約1%、研磨軌跡に 起因する楕円は約2%と微小である.

図 2.15 (b)に,端面直径が 1.4 mm のフェルール先端部の側面プロ フィールの 1 例を示す.

図2.16に、端面直径1.4 mmのフェルール先端部の3次元プロフィー ルの実測値の一例を示す.測定は、前述の光干渉測定器により行った. ただし、研磨条件は、研磨荷重 wが150 grf /mm²、弾性研磨盤の硬 さH_sが80とした場合の実験試料について示す.図2.16において、Z 軸のスケール単位はµm,X軸及びY軸のスケール単位は各々10 µmで 表示してある.下部にプロットされている記号表示は各々次の項目を示 している.RADIUSは球面の曲率半径、HEIGHTは光ファイバ端面の フェルール端面からの凹み深さ、OFFSETは球面の頂点の光軸からの 値心を示している.このうち、LINEARは球面の頂点の光軸からの直線 距離、(x,y)は球面の頂点のx軸及びy軸方向の座標位置を示してい る.ANGLEはフェルール・キー位置と直角方向(傾斜面方向=yy軸) を零度としたときの球面の頂点の位置の振れ角度を示している.(x,y) は球面の頂点のx軸及びy軸方向の振れ角度を示している.を示してい る.

図2.16では,斜め球面の曲率半径Rは各々14.8 mm及び15.8 mm, 光ファイバ端面のフェルール端面に対する凹み深さは各々-0.01 µm及



図2.14 研磨フィルム面に印加されたフェルールの研磨軌跡痕





(a). Interference fringe.
(b). polished profile.
図 2.15 研磨後のフェルールの端面の干渉縞,及び側面形状例

び-0.04 μm, 並びに斜め球面の頂点の光軸に対する偏心は各々9 μm 及び24 μmであった.

2) 曲率半径

図2.17に、弾性研磨盤の硬さH_sを基準として、フェルールの先端面 の半径b,及び研磨荷重wを変えた場合の、斜め球面の曲率半径Rの測 定値を示す.図2.17から、弾性研磨盤により斜め球面成形研磨を行っ た場合の研磨特性として次のことが判る.斜め球面の曲率半径Rは、弾 性研磨盤の硬さH_sが高くなるのに伴って急速に曲率半径Rは大きくな る.同様に、研磨荷重wが小さくなるにしたがって、曲率半径Rは大



図 2.16 フェルールの斜め球面の3次元形状の測定プロット



図 2.17 各パラメータによる斜め球面成形研磨面の曲率半径



きくなる. 更に, フェルールの先端面の半径bが大きくなるのに伴って, 曲率半径 R は大きくなる. 一方,別の視点で言えば,研磨荷重 w が大 きいとき,弾性研磨盤の硬さ H_s が低くなるのに伴って曲率半径 R は小 さくなり,フェルールの先端面の半径 b が小さくなると,曲率半径 R が 飽和してくる傾向が認められる. 一例を挙げれば,研磨荷重 w が 200 gr/mm²,フェルールの先端面の半径 b が 1 mmの場合,弾性研磨盤 の硬さ H_s が80と75における曲率半径 R は,各々12.5 mmと9.0 mm である. しかし, H_s が75と70における曲率半径 R は,各々9.0 mm と8.0 mmであり,曲率半径 R の差異は各々3.5 mm, 1.0 mmになる. 従って,フェルールの先端面の半径 b が一定の場合,曲率半径 R の 寸法 ばらつきを小さくするためには,弾性研磨盤の硬さ H_s を低くするか,研 磨荷車 w を許容できる範囲で大きくすることを推奨できる.

更に,図2.17によれば,フェルールの先端面の半径bが1 mmの場合,曲率半径Rの評価基準の5~12.5 mmを満足させるためには,硬さH_sは80以下の弾性研磨盤を使用して,研磨荷重wは200 gr/mm² にしなければならない.



図2.18は、本実験により得られた斜め球面の曲率半径Rの測定値の 寸法ばらつきの偏差を示す.図2.18において、ばらつきの偏差は各フェ ルールの先端面の半径り毎に得たものであり、研磨荷重 wが 200 gr/ mm²及び弾性研磨盤の硬さH_sが70の場合について示したものである. 図2.18から、この偏差は、フェルールの先端面の半径りに略比例して 増加することが判る.この結果から、フェルールの先端面の半径りは小 さいものが有利であると言える.

3) 球面頂点の偏心

図2.19に、斜め球面頂点の光軸に対する偏心とそのばらつきの偏差 を示す.図2.19において、偏心とそのばらつきは、各フェルールの先 端面の半径bの差異による、光ファイバ光軸を基準として測定したもの である.ただし、図2.19は、研磨荷重 wが200 gr/mm²、及び弾性 研磨盤の硬さH_sが70の場合について示したものである.図2.19から、 斜め球面頂点の偏心の偏差の最大値は38.5 µm となり、前述の評価基 準の50 µm 以内にあることが判る.

前述のように,弾性研磨盤による球面研磨法では,フェルール端面の



図 2.20 光ファイバの研磨端面のフェルール端面からの凹み深さ

中心が球面頂点になるように成形研磨されるので、この斜め球面頂点の 偏心は、研磨機の研磨特性より、むしろ、フェルールの先端形状及び精 度に大きく影響される.例えば、通常のコネクタ用フェルールの先端部 には、テーパ面取り部を設けてあるが、このようなフェルールを斜め球 面研磨した場合、研磨の進行につれて研磨面の中心が光軸から徐々にず れるので、斜め球面頂点の光軸からの偏心量が増加する.さらに、球面 研磨前のフェルール素材の先端面が、中心孔に対して偏心している場合 には、その偏心に比例して斜め球面頂点の偏心は大きくなる.この影響 を改善するために、高橋は、フェルール先端部に小径の直円筒部を設け た、新しいステップ・フェルールを開発した[15].このステップ・フェ ルールの先端部の構造は図2.12に示したものである.

4) 光ファイバ端面の凹み深さ

図2.20に,各端面直径のフェルールについて,光ファイバ端面のフェ ルール端面からの凹み深さのヒストグラムを示す.図2.20から,最大 凹み深さは-0.046 µm となり,前述の評価基準の-0.05 µm 以内にあ ることが判る.

ただし,硬さ,ヤング率,及び被研磨性などの材質特性が大きく異な



図 2.21 光ファイバの斜め球面研磨面からの反射戻り光

るフェルール面と光ファイバ面とを同時に研磨した場合,双方の研磨除 去量を完全に一致させることは物理的に困難である.この光ファイバ端 面の凹み量は,仕上げ工程の研磨フィルムの砥粒の材質,硬さ,メッ シュサイズ,及びその均一分布度,バインダーの材質,製造方法,及び 仕上げ研磨時間の長短などの多くの要因に依存する[16].従って,光 ファイバ端面の凹み量は,研磨装置の研磨機構と同時に仕上げ研磨フィ ルムの特性にも依存すると考えられる.

5) 反射戻り損失

図 2.21 は、各端面直径のフェルールについて、光源波長 λ = 1.310 µmにおける光ファイバ端面からの反射戻り光の実測値の総合ヒストグ ラムを示したものである. 図 2.21 から、反射戻り光の測定値は-66 dB 以下であり、前述の評価基準の-60 dB 以下の目標値を十分達成して いることが判る.

反射戻り光 B_R は第1章の式(1.8)により与えられる[17]. シングル モード光フアイバにおいて, n_1 =1.47, ω_0 =4.2 μ m, λ =1.310 μ m として,光ファイバ端面の傾斜角度が8度の場合,式(1.8)により計 算した反射戻り光 B_R の計算値は約-84 dB である.ただし,反射戻り



図2.22 APCコネクタの接続時の挿入損失

光の測定値は,使用する測定器の測定感度により,最小測定値は制限される.本論文の反射戻り光測定は,測定感度 - 72 dBの測定器を使用した [18].

6) 挿入損失

図 2.22 は、斜め球面の半径 b をもつ各フェルールについて、光源波 長 $\lambda = 1.310 \mu m$ における挿入損失のヒストグラムを示したものであ る.図 2.22 から、挿入損失の最大偏差値は (X + 3 σ) は 0.41 dB で あり、前述の評価基準の 0.5 dB 以内の目標値を満足している.

挿入損失は,前述の評価基準の各項目を集約した総合評価結果を示す ものであり,前述の適正なフェルール先端形状,偏心精度,及び適正な 仕上げ研磨フィルムの適用により,本論文の斜め球面成形研磨装置は, APC光コネクタフェルールの斜め球面成形研磨用として,機械特性及 び光学特性に関する基本的な性能を具備していることを示している.

2.6 評価実験結果の考察

斜め球面成形研磨装置において,特に実用上で重要な機能である,斜 め球面の曲率半径の成形限界,及び光ファイバ研磨面のフェルール端面 からの凹みの限界について取り上げて考察する.

2.6.1 球面の曲率半径と弾性研磨盤のたわみ変形

2.3.1 項の図2.7 (d)に示した,フェルールの円筒外縁からの球面頂 点の高さhは,弾性研磨盤の変形深さ(=h)に等しいものと仮定する. この場合,球面頂点の高さhは次の式(2.1)により求められる.

 $h = R^2 - \sqrt{R^2 - b^2} \cong b^2 / 2R \tag{2.1}$

ただし、b:フェルール先端部の半径

R:フェルール球面の曲率半径

式(2.2)から、球面曲率半径 R,球面頂点の高さ,及びフェルールの 先端部の半径 b は相互に関係のあることが判る.

弾性盤の硬さ(H_s)が、各々70、80及び90、研磨荷重wが、各々 100 grf/mm²、150 grf/mm²、及び200 grf/mm²、フェルールの 端面半径 bを1.0 mm、0.7 mm 及び0.5 mm であるとする. このと き、曲率半径 Rの値として図2.17の値を与え、式(2.1)により計算 した球面頂点高さ hを図2.23 にプロットして示す. ここで、研磨荷重 wが0 grf/mm²の場合、弾性研磨盤のたわみ変形深さ hは0 mm で あるとして外挿してある. 図2.23によれば、研磨荷重wが0 grf/mm² の場合には、弾性研磨盤は当然、変形しないから、弾性盤硬さ Hs、及 びフェルール先端部の半径 bの値とは無関係に球面頂点高さhは零とな る. 研磨荷重 wが 200 grf/mm²以下の範囲では、研磨荷重 wが増加 するのに伴って、フェルール球面頂点高さ h(=弾性研磨盤の変形深さ h)は、フェルール先端部の半径 b、及び研磨荷重 wに対応して、ほぼ 直線的に増加する. 一方、弾性研磨盤の硬さ H_sが低下するのに伴って、 フェルール球面頂点高さ h(=弾性研磨盤の変形深さ h)は、フェルー

2.6.2 弾性研磨盤による球面成形の限界条件

本論文の斜め球面成形研磨装置により,フェルール端面の斜め球面成





形研磨を行った場合,弾性研磨盤による球面成形の限界条件は次のよう になる[19].

1) フェルールの端面半径 b による限界条件

弾性盤の硬さ Hs が各々 70,80 及び 90 であるとし,研磨荷重 wが, 各々 100 grf/mm²,150 grf/mm²,及び 200 grf/mm²であるとす る.曲率半径 Rの値として,図 2.17 の値を与え,式(2.1)により計 算した球面頂点高さ h を図 2.24 にプロットして示す.図 2.24 はフェ ルールの端面半径 bが1.0 mm,0.7 mm及び0.5 mmについてプロッ トしたものである.図2.24から,フェルール先端部の半径 bが0.3 mm 以下になると,弾性研磨盤の硬さ H_s及び研磨荷重 wの数値に関わりな く,弾性研磨盤のたわみ変形深さ h は零に接近する.このことは,b< 0.3 mmの領域になると,本論文の斜め球面成形研磨装置によっては, フェルールの先端面が球面研磨されなくなることを示している.

2) 弾性盤の硬さ Hs による限界条件

研磨荷重wが,各々100 grf/mm²,150 grf/mm²,及び200 grf/ mm²,フェルールの端面半径bが1.0 mm,0.7 mm及び0.5 mmで あるとする.このとき,曲率半径Rの値として,図2.17の値を与え,弾 性盤の硬さを変えたとき,式(2.1)により計算した球面頂点高さんを 図2.25 にプロットして示す.図2.25 から,弾性盤の硬さH_sが約95 に接近すると,研磨荷重w,及びフェルールの端面半径bの数値に関わ りなく,弾性研磨盤のたわみ変形深さんは零に接近する.このことは, この領域になると,本論文の斜め球面成形研磨装置によっては,フェ ルールの先端面が球面研磨されなくなることを示している.

弾性盤の硬さが H_s >95の領域では,弾性盤の硬さHsやフェルール 先端部の半径bにより,弾性研磨盤のたわみ変形深さhが一意に決定さ れなくなる.ただし,通常使用されるFC及びSC型フェルールの先端 部の半径bは0.7 mm以上,球面曲率半径Rは5~12.5 mm程度で ある.その場合に必要な弾性盤の硬さHsは70~75であり,実用上問 題のないことが実験的に証明された.

ただし, MU型フェルールの場合は, フェルールの先端部の半径bは,



図 2.24 フェルール先端の半径 b と弾性研磨盤のたわみ変形深さ h



図 2.25 弾性研磨盤の硬さ H_s と弾性研磨盤のたわみ変形深さ h



(b). Air-gap z caused by withdrawal of optical fiber endfaces.
図 2.26 光ファイバ端面の凹みによる接続状態

ほぼ0.3 mm であるので,今後,その研磨条件については,更に検討 を要する.

2.7.3 光ファイバ端面のフェルール端面からの凹み

前述のように、フェルール端面の斜め球面研磨において、フェルール と光ファイバとの間で材質の硬さ、及びヤング率などの物性に差異があ る場合には、各々の被研磨性が異なってくるので、フェルールと光ファ イバの各々端面を均一に揃えて仕上げることは困難である.一般に、光 ファイバ端面がフェルール端面より、わずかに凹んだ状態になることが 多い.この凹み深さが大きい光ファイバ付きフェルールを使用した場合

<第2章>



には,一対の光コネクタで両方の光ファイバ端面を密着させるために, 軸方向に接触力を負荷しても,両光ファイバ端面間のエァギャップを消 去することは不可能になる. すなわち, このときには, フェルール端面 のみが弾性変形して,その軸方向のたわみ分だけ,光ファイバ端面も同 時に連動して変位し,両光ファイバ端面間のエァギャップは消去できな い. この状態を図 2.26 (a),(b)によって説明する. 図 2.26 において, Rは曲率半径, h, は球面頂点からフェルール孔の縁までの高さ, h, は球 面頂点から光ファイバ頂点の縁までの深さ,2fは光ファイバ・クラッド の直径を示す. 図2.26 (a)において, (a-1)はh₂ < h₁の状態を示す. こ の場合は、図2.26 (b)における(b-1)に示すように、各々光ファイバの 端面がフェルールの端面が接触する前に接触するので,エァギャップ8~ は生じない. 一方,図2.26 (a)において,(a-2)はh,>h,の状態を示 す.この場合には、図2.26 (b)の(b-2)に示すように、各々フェルール の端面が先に接触する.そのまま,接触力Wcを増加させると、フェル - ル端面が弾性変形するが、光ファイバも連動して変位することにな る. 従って, エァギャップzを消去することはできない.

エァギャップzを消去した状態で各々光ファイバを接続できる光ファ
イバの凹み深さ h,は,次の式(2.2)で計算できる.

 $h_2 \leq R^2 - \sqrt{R^2 - f^2} \cong f^2 / 2R$

(2.2)

式(2.2)により計算したエァギャップzを消去した状態で,接続で きる光ファイバ端面の許容凹み深さ h_2 を図2.27に示す.ただし,光ファ イバの直径2f = 0.125 mm,及び球面の曲率半径Rが5 mmから12.5 mmまで変化する場合について計算した.図2.27から,フェルールの 斜め球面の曲率半径Rの減少に伴って,光ファイバ端面の許容凹み深さ h_2 は大きくなることが判る.

2.7 まとめ

第2章では、最初に、APCコネクタの大量生産に不可欠な、フェ ルール端面の球面成形研磨装置を提案した.続いて第2章では、本球面 成形研磨装置の実験結果にもとずいて、球面成形の研磨メカニズムを考 察すると共に、研磨特性の評価を行った。その結果は次のように要約で きる.

1) 研磨軌跡

研磨傷の自動修復を目的として,公転及び自転の複合得ん運動をする 弾性研磨盤に固定保持力したフェルールの先端面を押し付けて球面成形 研磨法,及び装置による研磨軌跡は十分に具現できた.

2) 曲率半径

研磨実験データから、フェルールの先端面の半径 b が 0.5 mm ~ 1.0 mmのフェルールについて、曲率半径の目標値5 mm ~ 12.5 mmは、弾性盤の硬さは H_s < 80、研磨荷重は $w = 200 \text{ grf/mm}^2$ の研磨条件の設定により得られた.

3) 斜め球面の頂点の光軸からの偏心

先端面の半径 b が 0.5mm ~ 1.0mm のステップ・フェルールについ て,研磨荷重 w が 200 gr/mm²,及び弾性研磨盤の硬さ H_sが 70 の場 合,斜め球面頂点の偏心の偏差の最大値は 38.5 μm となり,前述の評 価基準の50 µm 以内が得られた.

4) 光ファイバ端面の凹み

先端面の半径 bが 0.5 mm ~ 1.0 mm のステップ・フェルールについて,研磨荷重 wが 200 gr/mm²,及び弾性研磨盤の硬さ H_s が 70 の場合,最大凹み深さは $-0.046 \mu m$ となり,評価基準の $-0.05 \mu m$ 以内が得られた.

5) 反射戻り光

先端面の半径 bが 0.5mm ~ 1.0mm のステップ・フェルールについて, 光源波長 λ = 1.310 μm における反射戻り光の測定値は-66 dB以下が得られた.

6) 挿入損失

先端面の半径 b が 0.5mm ~ 1.0mm のステップ・フェルールについ て、光源波長 λ = 1.310 μm における挿入損失の最大偏差 (X+3σ)は 0.041 dB 以下が得られた.

7) 球面の成形限界

フェルール端面の研磨球面の曲率半径Rは、フェルール端面の弾性研 磨盤面への埋没深さhと、フェルール先端部の半径bとにより一意的に 決定されることを実験的に示した.本論文による斜め球面成形研磨装置 には球面の成形限界がある.ただし、フェルール先端部の半径bが0.3 mm以上の場合、または弾性研磨盤の硬さHsが95以下の場合には、本 論文の球面研磨法を適用できることを実験的に証明できた.

8) 光ファイバ端面の凹みの許容深さ

フェルール端面からの光ファイバ端面の凹みの許容深さは,フェルールの斜め球面の曲率半径に依存することを示した.

第2章参考文献

- M. Takahashi, "Optical Fiber end-surface Polishing Device," US Patent. No. 4,979,334. Dec 25, 1990.
- [2] M. Takahashi, "Elastic Polishing Plate Method and Conditions for Forming Angled Convex Surface on Ferrule Endface," IEEE Journal of Lightwave Technology, Vol. 15, No. 9, pp.1675 - 1680, 1997.
- [3] Ralph R. Doyle, "MULTIPLE OPTICAL FIBER POLISHING APPARATUS," US Patent No. 4,693,035. 1987.
- [4] James P. Luther, "Polishing Method," US Patent No. 5.136,820. 1992.
- [5] 落合俊宏,他,"光コネクタ中子の端面凸球面研磨方法,"特許公報 昭 61-192460.1986.
- [6] 機械設計便覧編纂委員会,"機械設計便覧," 丸善株式会社, p. 1873.(1973)
- [7] 機械設計便覧編纂委員会,"機械設計便覧第3版," 丸善株式会社, p.845 (1992)
- [8] International Electrotechnical Commission, "INTERNATIONAL STANDARD, IEC 874-7, Connectors for optical fibers and cables Part 7 : Sectional specification for fiber optic connector-Type FC," 1993.
- [9] "JIS C5970-1987, F01 Type Connectors for Optical Fiber Cords," Japanese Industrial Standards Committee, 1987.
- [10] International Electotechnical Committee, "INTERNATIONAL STANDARD, IEC874-14, Connectors for optical fibers and cables Part 7 : Sectional specification for fiber optic connector-Type SC," 1993.
- [11] "光製品カタログ,"株式会社 精工技研, 1996.
- [12] "技術指導資料: SC Type Fiber Optic Connector 図面," NTT アドバンステクノロジー株式会社, 1989.
- [13] "技術指導資料: MU Type Fiber Optic Connector 図面," NTT アドバンステクノロジー株式会社, 1994.
- [14] カタログ,自動コネクトチェック干渉計システムACCIS,NTTア

ドバンステクノロジ株式会社, (1995)

- [15] M. Takahashi, " Optical Connector Ferrule," US Patent No. 5,140,660. 1992.
- [16] 松永和夫,小薮国夫,大平文和:光ファイバコネクタ用 S₁O₂ 研磨 フィルムの開発,1997 信学会春期大会,C-311,1997.
- [17] A. Benner, et al, "Low-reflectivity in-line variable attenuator utilizing optical fiber taper," IEEE J. Lightwave Technology, Vol. 8, pp. 703-718, 1977.
- [18] "Instruction manual for RM-3000," JDS Fitel INC, 1995.
- [19] M. Takahashi, "Elastic Polishing Plate Method and Conditions for Forming Angled Convex Surface on Ferrule Endface," IEEE Journal of Lightwave Technology. Vol. 15, No. 9, pp. 1675 - 1680, September, 1997.

第3章 テーパ・フェルール付きAPCコネクタの解析 - 1 フェルール回転角度 $\varphi = 0$ 度における接続特性

3.1 まえがき

PCコネクタでは、フェルールの接続端面が光ファイバの光軸に対し て直角球面に成形研磨されている.一方,APCコネクタでは、フェ ルールの接続端面が、光ファイバの光軸直角面に対して斜め球面されて いる.従って、APCコネクタに特有な現象として、各々光コネクタ部 品間の整列キーと整列キー溝との間に介在する隙間により、フェルール が相互に円周方向に若干回転した状態で接続される、この場合、各々 フェルールの斜め球面はV字形状に開くので、光ファイバ端面間のエァ ギャップが大きくなり挿入損失を増大させるので、接続の互換性を阻害 することは明らかである.APCコネクタの接続特性を考える上で、こ の接続時のフェルール間の回転は非常に重要である[1].(この接続時の フェルール間回転による接続特性については、第4章で記述する.)

しかしながら,APCコネクタに関する論文,特許などは,高橋のも のを除いては非常に少ない[2]-[9].従って,第3章では,テーパ・フェ ルールを使用したAPCコネクタの基本的な形状特性と接続特性を明ら かにするため,テーパ・フェルールの端面傾斜角度や,斜め球面の曲率 半径などをパラメータとして取り扱うが,フェルール回転角度が0度と 仮定して解析を実施する.すなわち,本章では,斜め球面の光軸からの 偏心,接続時の各々テーパ・フェルールの斜め球面の接点の光軸ZZか らの偏心,光ファイバ端面の接触角度,及び光ファイバ端面間に生ずる エァギャップについて,テーパ・フェルールの基本的な形状特性,及び 接続特性の理論解析を行う.

1) 斜め球面の傾斜角度

標準のシングルモード光フアイバ用APCコネクタの場合,光ファイ バの接続端面からの反射戻り光を-60 dB以下にするため,フェルール の接続端面の傾斜角度は通常8度に選定されている[10].ただし,例外



図3.1 FC型,及びSC型テーパ・フェルールの研磨前の形状例

的にドイツのPTTは9度の傾斜角度を採用している[11]. そのほか に,光源波長λ=1.550 μm帯の光伝送において,光伝送損失を低減した 分散シフト光ファイバ (Dispersion shifted optical fiber)が使用 されている.分散シフト光ファイバは,標準のシングルモード光フアイ バよりもモードフィルド半径が小さいので,この反射戻り光を-60 dB 以下にするため,高橋によれば,フェルールの接続端面の傾斜角度は12 度を要することが指摘されている[12]. (付録1参照)

従って,第3章以降では,この斜め球面の傾斜角度が8度と12度の 場合の形状特性及び接続特性について記述する.

2) フェルールの端面形状による斜め球面頂点の偏心

初期のAPCコネクタには、従来のPCコネクタ用フェルールが、そのまま使用されていた.整列スリーブ孔に円滑に挿入するため、このPCコネクタ用フェルールの先端部には、軸方向に30度から40度のテーパ面取り加工が施されている.本論文中では、この形式のフェルールをテーパ・フェルール(Tapered-ferrule)と呼称する.図3.1に、現在最も広く使用されているFC/PC型及びSC/PC型コネクタ用のテーパ・フェルールの研磨成形前の端面形状例を示す[13],[14].

APCコネクタ用フェルールの斜め球面の成形研磨には,第2章で記述したように,公転及び自転の複合運動をする弾性研磨盤上に,固定保持したフェルール端面を押し付けて研磨する方式の球面研磨装置の使用が主流である.その斜め球面はフェルール端面の円形外縁の中心点を基

準として,同心円状に成形研磨される.従って,斜め球面成形研磨面の 頂点は,研磨の進行につれて,フェルール中心にある光ファイバ光軸か ら徐々に偏心していく[15].よって,第3章では,このフェルール端面 形状と斜め球面の頂点の偏心との関係について記述する.

3) 斜め球面での曲率半径値の差異

第2章で記述したように,研磨により斜め球面を成形した後のフェル - ル端面の曲率半径値には,若干のばらつきが不可避である.従って, 第3章では,この曲率半径値の差異と形状特性及び接続特性との関係に ついて記述する.

3.2 テーパ・フェルールの形状特性の理論解析

3.2節では、初めに、テーパ・フェルール端面を斜め球面研磨した場合の、斜め球面頂点の光ファイバ光軸からの偏心の生成機構について理論解析を行う.次に、テーパ・フェルールの先端部の寸法諸元、及び端面傾斜角度、斜め球面の曲率半径などの研磨条件をパラメータとして、

斜め球面頂点の光ファイバ光軸ZZからの偏心,接続時における斜め 球面の接点の光軸ZZからの偏心,及び光ファイバ端面間に生成される エァギャップについて数値的に明らかにするため,理論解析を行った.

3.2.1 斜め球面頂点の光軸からの偏心の生成機構

図3.2は、斜め球面の頂点の光ファイバ光軸からの偏心の生成機構を 求める解析図である.ただし、図3.2は斜め球面研磨前に斜め平面研磨 を行った後の形状を示す.斜め球面の頂点の光ファイバ光軸からの偏心 は、本論文による斜め球面成形研磨装置により、テーパ・フェルール端 面を研磨した場合に生ずる.図3.2に示す斜め平面研磨の状態におい て、フェルール先端部の傾斜角度 β のテーパ面取りの斜面を線分 I 及び II、傾斜角度 θ_1 の斜め研磨面を線分 IIとする.このとき、斜め球面成形 研磨面の中心点のyy座標 C(y)は、線分 I と線分 II の交点のyy座標A (y)、及び線分 II と線分 II との交点のyy座標 B(y)を結ぶ線分 II の 2 分 の 1 の点に位置する.Lは、線分 II と直角(=光軸ZZに対する傾斜角度 θ)であって、かつ、yy座標 C(y)を通る線分を示す.この場合、yy座



図 3.2 テーパ・フェルールの斜め球面の頂点の光軸 ZZ からの 偏心 S_cの 生成 機構

標 A(y)及びyy 座標 B(y)の光軸 ZZ からの距離関係は, A(y)> B(y)に なる. 従って, 斜め球面成形研磨面の中心点のyy 座標 C(y)点は光軸 ZZ と一致せず, 図3.2に示したように, S_{co}だけ光軸 ZZ から偏心する. m_c は, 斜め球面成形研磨の軸方向の加工原点の位置を示す. C(y)点は, テ - パ・フェルール端面を斜め球面成形研磨する時, 研磨面の基準中心に なる.

図3.2において, 点線及び黒点で示したプロフィールは, 斜め球面の 成形研磨の後の状態を示す.上記の研磨基準により斜め球面研磨を行っ た場合, 次のようにフェルール端面状態は変化する. すなわち, 各々座 標点 A(y), B(y), 及び C(y) は, 新座標点 A'(y), B'(y), 及び C'(y) に移動する.線分 L は白矢印で示すように,線分 II に並行に線分 L'に 移行する.研磨面の中心点は, 斜め平面の時の中心点 C(y)から, 斜め 球面研磨面の頂点 P_{c1} に変化すると共に, 光軸 ZZ に対する偏心値は大 きくなる.研磨端面プロフィールはCから C' に拡大して, 面積及び偏 心値が大きくなる.

始八τ



図 3.3 斜め球面研磨後のテーパ・フェルールの斜め球面の 頂点の光軸 ZZ からの偏心 S_{ct}

図 3.2 から,研磨面の基準中心 *C(y)*の光軸 ZZ からの偏心 *S_{co}*は次の手順で求めることができる.

図 3.2 から,各々線分Ⅰ,Ⅱ,及びⅢは次の式(3.1)~(3.3)で表 わすことができる.

称万1	$y = -z \tan p + b$	(0.1)
線分Ⅱ	$y = -z \tan \beta - b$	(3.2)
線分Ⅲ	$y = \frac{m_C}{\tan\theta_1} - \frac{z}{\tan\theta_1}$	(3.3)

(2 1)

従って, A(y,z), 及びB(y,z)の各々座標は, 次の連立式(3.4),(3.5) で求めることができる.

$$A(yz) \quad \begin{pmatrix} y = -z \tan \beta + b \\ y = -z/\tan \theta_1 + m_c/\tan \theta_1 \end{pmatrix}$$
(3.4)

$$B(yz) \quad \begin{cases} y = -z \tan \rho - b \\ y = -z/\tan \theta_1 + m_c/\tan \theta_1 \end{cases}$$
(3.5)

A(y), 及びB(y)の各々座標は, 連立式(3.4), (3.5)から次の式(3.6), (3.7)で求めることができる.

<第3章>

$$A(y) = \frac{m_c \cdot \tan \beta - b}{\tan \theta_1 \cdot \tan \beta - 1}$$
(3.6)

$$B(y) = \frac{m_c \cdot \tan \beta - b}{\tan \theta_1 \cdot \tan \beta + 1}$$
(3.7)

 $\varepsilon \in U$, $b \cdot \tan \theta_1 \le m_c$.

研磨基準中心点になる yy 座標 C(y), すなわち, 光軸からの偏心 S_{co} は, 式(3.6), (3.7)から次の(3.8)式で求められる.

$$C(y) = S_{co} = \left[\left(A(y) + |B(y)| \right) / 2 \right] - |B(y)|$$

= $\left[\left(A(y) - |B(y)| \right) / 2 \right]$ (3.8)

図 3.3 は, 斜め球面成形研磨した後のテーパ・フェルールの先端部を 示したものである. 図 3.3 において, P_{c1}は斜め球面の頂点, S_{c1}は頂点 P の光軸 ZZ からの偏心, O₁は球面曲率半径 R₁の中心, αは線分 O₁, P と線分 A'(y)C'(y)の鋏角を各々示す.

斜め球面の頂点 *P_{c1}*の光軸 ZZ からの偏心 *S_{c1}*は,次の式(3.9)により計算できる.

$$S_{C1} = \left[\left(A(y) + |B(y)| \right) / 2\cos\theta_1 \right] + R_1 (1 - \cos\alpha) \tan\theta_1$$

$$(3.9)$$

$$\hbar \hbar \mathcal{E} \,\mathcal{U}, \quad \alpha = \sin^{-1} \left[\left(A(y) - C(y) \right) / R\cos\theta_1 \right] \,.$$

式 (3.9) により計算した, 斜め球面の頂点位置 P_{c1} の光ファイバ光 軸 ZZ からの偏心 S_{c1} を図 3.4に示す. 図 3.4は, FC型テーパ・フェ ルールについて示したものである. ただし, FC型のテーパ・フェルー ルの斜め球面の傾斜角度 θ_{I} が 8 度及び 12 度, テーパ角度 β が 30 度, 軸 方向研磨基準点位置 m_{c} が 0.25 mm, フェルール半径 bが 1.25 mm と して, 斜め球面の曲率半径 R_{I} が 5 mm から 2.5 mm おきに 12.5 mm まで変化した場合について計算した.

図 3.4では、F C 型テーパ・フェルールについて、傾斜角度 θ_1 が 8 度 及び12度の場合、斜め球面の頂点 P_{c1} の光ファイバ光軸ZZからの偏心 S_{c1} は、102~114 µm 及び150~166 µm と各々大きな数値を示す. テーパ・フェルールでは、斜め球面の頂点 P_{c1} の光軸ZZからの偏心 S_{c1}



図 3.4 FC/APCコネクタ用テー パ・フェルールの斜め球面 の頂点 P_{c1}の光軸 ZZ からの偏心 S_{c1}

は,斜め球面の傾斜角度 θ₁,フェルール外径 2b,及び斜め球面の曲率半径 R,に依存して変化することが図 3.4 から判る.

3.2.2 斜め球面接点の光軸からの偏心及び接触角度

テーパ・フェルール付APCコネクタの接続時において,テーパ・フェルールの斜め球面接点の光軸からの偏心に影響するパラメータとして,前項の斜め球面頂点P_{c1}の光軸ZZからの偏心S_{c1},ならびにテーパ・フェルールの斜め球面の曲率半径 R₁, R₂の差異を取り上げ,斜め球面上の接点の偏心について次に解析する.

図 3.5 (a),(b) は,斜め球面の曲率半径 R_1 , R_2 が同一または異なる 一対のテーパ・フェルール1及び2を,整列スリーブ孔に挿入接触させ た状態について,各々テーパ・フェルールの斜め球面の接点 Q_c の偏心 e_c 及び接触角度 ψ_c を求める解析図である.

図 3.5 (a) において、 P_{c1} 、 P_{c2} は各々テーパ・フェルール端面の斜め球面の頂点の位置を示す。 O_1 及び O_2 は、各々テーパ・フェルール1及び2の球面曲率半径 R_1 及び R_2 の中心点を示す。この場合、各々フェ



(b). $R_1 > R_2$, $\varphi = 0$ degree.

図 3.5 斜め球面の曲率半径 R₁, R₂の差異によるテーパ・フェ ルール端面接点 Q_cの光軸 ZZ からの偏心 e_c, 及び接 触角度 ψ_c.

ルール端面は球体の1部分であると考えられるから,各斜め球面の接点 Q_c は常に中心点 O_1 及び O_2 を結ぶ線 分L上にある. H_{c1} 及び H_{c2} は, テーパ・フェルール1及び2の曲率半径の中心点 O_1 及び O_2 の光ファイ バ光軸ZZからの距離を示す. ψ_c は,各テーパ・フェルールの斜め球面 の接点 Q_c の光軸ZZに対する接触角度を示す.

図 3.5 (a) は、テーパ・フェルール1と2の曲率半径 R₁, R₂が同一 の場合の各テーパ・フェルールの斜め球面の接点 Q_cの位置を示す.こ の場合、テーパ・フェルール1と2の曲率半径 R₁, R₂の中心点O₁, O₂ は光軸 ZZ に対して対称、かつ、等距離 H_{c1}, H_{c2}に位置する.従って、



図 3.6 テーパ・フェルール1の曲率半径 R_1 の中心点 O_1 の光軸 ZZからの 距離 H_{c1} (= A-B).

斜め球面の接点Q_cは光軸ZZ上に位置するので,斜め球面の接点Q_cの 光軸ZZからの偏心 e_cは零になる.

図 3.5 (b) は、テーパ・フェルールの斜め球面の曲率半径 R_1 、 R_2 が、 $R_1 > R_2$ の場合の斜め球面の接点 Q_c の偏心 e_c を示す. この場合、テー パ・フェルール2の曲率半径 R_2 の中心 O_2 'は、同一曲率半径の時のテー パ・フェルール2の中心点 O_2 と、斜め球面の頂点 P_{c2} とを結ぶ線分上 を白矢印で示すように移動する. 曲率半径 R_1 、 R_2 の中心点 O_1 、 O_2 'の 光軸 ZZ からの距離 H_{c1} 、 H_{c2} の関係は、 $H_{c1} > H_{c2}$ になる. 従って、斜 め球面接点 Q_c は光軸ZZ から e_c で示す偏心した位置になる.

各々テーパ・フェルールの斜め球面の接点 Q_c は、曲率半径 R_1 , R_2 の中心点 O_1 , O_2 の光軸ZZからの距離 H_{c1} , H_{c2} の合計値を、各テーパ・フェルールの斜め球面の曲率半径 R_1 , R_2 の比率で分割した位置にあることが図 3.5 から判る.従って、斜め球面の曲率半径 R_1 , R_2 の差異によるテーパ・フェルール端面の光軸ZZに対する接点 Q_c の偏心 e_c は、次の式 (3.10) より求めることができる.

$$e_{c} = \frac{1}{\cos\psi_{c}} \left[\frac{R_{1} \left(\left| H_{c1} \right| + H_{c2} \right)}{R_{1} + R_{2}} - \left| H_{c1} \right| \right]$$
(3.10)

ここで、テーパ・フェルール1の曲率半径 R_1 の中心点 O_1 の光軸ZZ からの距離 H_{c1} は、図3.6に示す解析図により、次の式(3.11)より求めることができる.

$$H_{c1} = R_1 \sin \theta_1 - S_{c1} \cos \theta_1 \tag{3.11}$$

同様にして、テーパ・フェルール2の曲率半径 R_2 の中心点 O_2 の光軸 ZZ からの距離 H_{c2} は、次の(3.12)より求めることができる.

$$H_{c_2} = R_2 \sin \theta_1 - S_{c_2} \cos \theta_1 \tag{3.12}$$

従って,式(3.10)は,次の式(3.13)のように書き換えることが できる.

$$e_{c} = \frac{R_{1} \left[\left| R_{1} \sin \theta_{1} - S_{c1} \cos \theta_{1} \right| + \left(R_{2} \sin \theta_{1} - S_{c2} \cos \theta_{1} \right) \right]}{\left(R_{1} + R_{2} \right) \cos \psi_{c}}$$
$$- \frac{\left| R_{1} \sin \theta_{1} - S_{c1} \cos \theta_{1} \right|}{\cos \psi_{c}}$$

$$=\frac{R_{1}(R_{2}\sin\theta_{1}-S_{c2}\cos\theta_{1})-R_{2}|R_{1}\sin\theta_{1}-S_{c1}\cos\theta_{1}|}{(R_{1}+R_{2})\cos\psi_{c}}$$
(3.13)

ここで、斜め球面の接点の接触角度 ψ_c は次の式(3.14)より求めることができる.

$$\psi_{c} = \sin^{-1} \left(\frac{|H_{c1}| + H_{c2}}{R_{1} + R_{2}} \right)$$

$$=\sin^{-1}\left[\frac{|R_{1}\sin\theta_{1}-S_{c1}\cos\theta_{1}|+(R_{2}\sin\theta_{1}-S_{c2}\cos\theta_{1})|}{R_{1}+R_{2}}\right]$$
(3.14)

フェルール回転角度が $\varphi = 0^{\circ}$ の場合については、テーパ・フェルール端面接点 Q_cの光軸 ZZ からの偏心 e_c、及び接触角度 ψ_c は、以上の式 (3.13) 及び式 (3.14) により求めることができる.



 $R_1 > R_2, \ \varphi = 0^{\circ}$

図 3.7 斜め球面の頂点 P_{c1}, P_{c2}の光軸 ZZ の偏心 S_{c1}, S_{c2} か らのテーパ・フェ ルー ル端面の接点 Q_cの偏心 e_c.

フェルールの回転角度 $q = 0^{\circ}$ の場合に限定されるが, テーパ・フェ ルール端面の接点 Q_c の偏心 e_c は,式(3.13)以外に,図3.7の解析図 によっても簡単に求めることができる.図3.7において,M,Nは斜め 球面の頂点 P_1, P_2 の光軸 ZZ の偏心 S_1, S_2 を合計した($S_1 + S_2$)の距離 をおいて,斜め球面の傾斜角度 θ_1 に並行に,かつ,斜め球面の頂点 P_1, P_2 を通る仮想線である.この場合,各々テーパ・フェルールの斜め球面の 接点 Q_c は,($S_1 + S_2$)を斜め球面の曲率半径 R_1 , R_2 の比率で分割した 位置にある.従って,テーパ・フェルール端面の接点 Q_c の偏心 e_c は, 次の簡便な式(3.15)より求めることができる.

$$e_{c} = \left| S_{c1} - \frac{R_{1} \left(S_{c1} + S_{c1} \right)}{R_{1} + R_{2}} \right| = \left| \frac{R_{2} \cdot S_{c1} - R_{1} \cdot S_{c2}}{R_{1} + R_{2}} \right|$$
(3.15)

ただし、 $\varphi = 0$ 、 $R_1 \ge R_2$.

従って、斜め球面接点 Q_c の光軸ZZに対する偏心 e_c は、斜め球面の 頂点 P_{c1} , P_{c2} の光軸ZZからの偏心 S_{c1} , S_{c2} , 及び斜め球面の曲率半径 $R_{1,}$, R_2 の差異に依存して決まることが式(3.15)から判る.

図 3.8 は,式(3.13),または,式(3.15)により計算した斜め球面 接点 Q_cの光軸 ZZ に対する偏心 e_cを示す.ただし,斜め球面の傾斜角

<第3章>



図 3.8 斜め球面の曲率半径 R₁, R₂の差異によるテーパ・フェ ルール 端面の接 点Q_cの光軸 ZZ に対する偏心 e_c.

度 θ_1 が8度及び12度として、一対のテーパ・フェルールの斜め球面の 曲率半径 R_{I_1} , R_2 が、各々5 mm、7.5 mm、10 mm、及び12.5 mm の場合について計算した.

この斜め球面接点 Q_c の光軸ZZに対する偏心 e_c は、斜め球面の傾斜

<第3章>

角度 θ_1 ,及びテーパ・フェルールの斜め球面の曲率半径 R_1 , R_2 の差異に依存することが図3.8から判る.更に、曲率半径 R_1 , R_2 の差異が大きい組合せの接続では、この偏心 e_c が増加することを図3.8では示している.

1例として、図 3.8 では、斜め球面の傾斜角度 θ_1 が12度、一対のテ ーパ・フェルールの斜め球面の曲率半径 R_1 , R_2 が、各々12.5 mmと 12.5 mm、及び12.5 mmと5 mmの場合、テーパ・フェルール端面 の接点 Q_c の偏心 e_c は、各々0 µmと75.7 µmになった。同様に、斜 め球面の傾斜角度 θ_1 が12度、一対のテーパ・フェルールの斜め球面の 曲率半径 R_1 , R_2 が、各々7.5 mmと7.5 mm、及び7.5 mmと5 mm の場合、テーパ・フェルール端面の接点 Q_c の偏心 e_c は、各々0 µmと 36.7 µmになった。

式 (3.14) によって計算した,斜め球面上の接点 Q_c の光軸 ZZ に対 する接触角度 ψ_c を図 3.9 に示す.ただし,斜め球面の傾斜角度 θ_i が 8 度及び 12 度,一対のテーパ・フェルールの斜め球面の曲率半径 R_{I_i} R_2 の組合せが,各々 5 mm, 7.5 mm, 10 mm 及び 12.5 mm の場合に ついて計算した.

この斜め球面の接点Q_cの光軸ZZに対する接触角度 ψ_c は, 斜め球面 の傾斜角度 θ_i , 及びテーパ・フェルールの斜め球面の曲率半径 R_i , R_2 の差異に依存することが図 3.9 から判る.更に,曲率半径 R_i , R_2 の差 異が大きい組合せ接続では,接触角度 ψ_c は小さな値になることを図 3.9 では示している.1例として,図 3.9 から,斜め球面の傾斜角度 θ_i が12 度,一対のテーパ・フェルールの斜め球面の曲率半径 R_i , R_2 の組合せが, 各々 12.5 mm と12.5 mm,及び 12.5 mm と5 mm の場合,この斜 め球面の接点Q_cの光軸ZZに対する接触角度 ψ_c は,各々 11.3度と10.9 度になった.同様に,斜め球面の傾斜角度 θ_i が8度,一対のテーパ・フェ ルールの斜め球面の曲率半径 R_i , R_2 の組合せが,各々 12.5 mmと12.5 mm,及び 12.5 mm と5 mmの場合,各々接触角度 ψ_c は7.5度と7.3 度になった.いずれの場合も,接触角度 ψ_c は斜め球面の傾斜角度 θ_i よ り小さくなる.



図 3.9 斜め球面の接点 Q_c の光軸 ZZ に対する接触角度 $\psi_{c.}$

3.2.3 光ファイバ端面間のエァギャップ

ー対のテーパ・フェルールの斜め球面上で,斜め球面の接点Q_cの光 ファイバ光軸ZZからの偏心*e*_cにより,条件によってはエアギャップ*Z*_c が光ファイバ光軸ZZ上に生ずる.図3.10は,光ファイバ端面の光軸 ZZにおけるエァギャップ*Z*_cを求める解析図である.エァギャップ*Z*_cは



図 3.10 光ファイバ端面の光軸 ZZ におけるエァギャップ Z_c

テーパ・フェルール1及び2によるエァギャップ*Z_{c1}, Z_{c2}*を合計した光 ファイバ光軸ZZ上のエアギャップ*Z_c*を示す.図3.10から,エァギャッ プ*Z_c*は次の手順で求めることができる.

テーパ・フェルール1及び2によるエァギャップ Z_{c1} , Z_{c2} は, 次の式 (3.16), (3.17) により求めることができる.

$$Z_{c1} = R_1^2 - \sqrt{R_1^2 - e_c^2} \cong e_c^2 / 2R_1$$
(3.16)

$$Z_{c2} = R_2^2 - \sqrt{R_2^2 - e_c^2} \cong e_c^2 / 2R_2$$
(3.17)

従って、エァギャップ Z_c は次の式 (3.18) により求めることができる

$$Z_{c} = Z_{c1} + Z_{c2} \approx \left(e_{c}^{2}/2R_{1}\right) + \left(e_{c}^{2}/2R_{2}\right)$$

$$Z_{c} \approx \left(R_{1} + R_{2}\right)e_{c}^{2}/2R_{1} \cdot R_{2}$$
(3.18)

式 (3.18) によれば、エァギャップ Z_c は、各々テーパ・フェルール の斜め球面上の接点 Q_c の、光軸ZZからの偏心 e_c の2乗に比例すると 共に、各々曲率半径 R_1 、 R_2 に反比例する.

前述の式 (3.15) によれば, 各々テーパ・フェルールの斜め球面の接 点 Q_cの光軸 ZZ からの偏心 e_cは, 各々テーパ・フェルールの斜め球面



図 3.11 接触圧力ゼロの時のテーパ・フェルールの光ファイバ 光軸 ZZ 上のエァギャップ Z_c

の頂点 P_{c1}, P_{c2}の光軸 ZZ からの偏心 S_{c1}, S_{c2} に各々比例する.

図 3.11 は,式 (3.18) により計算した,接触圧力が零の時の光ファ イバ光軸ZZ上のエァギャップ Z_c を示す.斜め球面の傾斜角度 θ_1 が8度 及び12度,一対のテーパ・フェルールの斜め球面の曲率半径 R_{I_r} R_2 が, 各々 5 mm, 7.5 mm, 10 mm及び12.5 mmの場合について計算し た.図3.11によれば,接触圧力が零の時,光ファイバ光軸ZZ上のエァ ギャップ Z_c は,斜め球面の傾斜角度 θ_1 ,及びテーパ・フェルールの斜 め球面の曲率半径 R_1 , R_2 の差異に依存する.更に,斜め球面の曲率半 径 R_1 , R_2 の差異が大きい組合せの接続になるのに伴って,エァギャップ Z_c は急速に増加する.1例として,図3.11によれば,斜め球面の傾斜 角度 θ_1 が12度,一対のテーパ・フェルールの斜め球面の曲率半径 R_1 , R_2 が,各々12.5 mmと12.5 mm,及び12.5 mmと5 mmの場合, この光ファイバ光軸上のエァギャップ Z_c は,各々0 µmと0.80 µmで あった.同様に,斜め球面の傾斜角度 θ_1 が8度,一対のテーパ・フェ ルールの斜め球面の曲率半径 R_1 , R_2 が,各々12.5 mmと12.5 mm, 及び12.5 mmと5 mmの場合,エァギャップ Z_c は各々0 µmと0.38 µmになった.

図 3.11によれば、この光ファイバ光軸上のエァギャップ Z_c は、テーパ・フェルールの斜め球面の曲率半径 R_1 , R_2 の差異が大きいほど増加する.また、斜め球面の曲率半径 R_1 , R_2 が同一の組合せでは、エアギャップ Z_c は常に零になる.

3.3 テーパ・フェルールの接続特性の理論解析

第3.3項では,第3.2項で理論解析した形状特性をもっているテーパ・フェルールを使用して構成したAPCコネクタの接続特性について,光ファイバ端面間のエァギャップZ_cを消去する接続原理,及びエァ ギャップZ_cを消去するために要する軸方向の接触力などの接続特性について記述する.

3.3.1 光ファイバの接続原理

図3.12はAPCコネクタの接続時におけるエアギャップZ_cの消去の メカニズムの説明図である.光ファイバ端面間のエアギャップZ_cは,軸 方向に接触力W_cを負荷して,斜め球面の中心部の微小な面積部分を円 形平面に弾性変形させて消去される[13].この接触力W_cは,コネクタ・ プラグに内蔵された圧縮コイルばね力W_oにより負荷される.しかし, FC型光コネクタの圧縮コイルばね力W_oの実効値は,寸法の制約によ



(a). Forve W_c not loaded.
 (b). Force W_c loaded.
 図 3.12 光ファイバ光軸上のエァギャップ Z_cの消去原理

り,0.7±0.2 kgfと小さな値に規定されている,従って,テーパ・フェ ルールの斜め球面接点Q_cの,光ファイバ光軸ZZからの偏心 e_c に光ファ イバのモードフィルド半径aを加算した半径値が,前記の圧縮コイルば ねカ W_o により形成される円形平面の半径範囲内にある時にのみ,光 ファイバ端面は密着できる.もし,所要の軸方向接触力 W_c が圧縮コイ ルばね力 W_o より大きい場合には,光ファイバ端面は密着しない.

3.3.2 エアギャップの消去に要する接触力

曲率半径 R₁ 及び R₂ の 2 個の中実球面を接触させて,接触力 Wで接触 点を押した場合,球面の弾性変形により生ずる円形平面の半径 r は,次 の Hertz の弾性方程式(3.19)により与えられる[16].

$$r = \sqrt[3]{\frac{3\pi \cdot R_1 \cdot R_2(\kappa_1 + \kappa_2)}{4(R_1 + R_2)}} \cdot \sqrt[3]{W}$$
(3.19)

ただし.

$$\kappa_1 = (1 - v_1^2) / \pi \cdot E_1, \ \kappa_2 = (1 - v_2^2) / \pi \cdot E_2$$

$$r = e_c + a$$

 $E_1 = E_2: フェルールのヤング率$ $v_1 = v_2: フェルールのポアソン比$ $e_c: 球面接点 θ の光軸 ZZ からの偏心$ <math>a: 光ファイバ半径

各々テーパ・フェルールの材質をジルコニア・セラミックとして、ヤング率 $E_1 = E_2 = 15,000 \text{ kgf/mm}^2$ 、ポアソン比 $v_1 = v_2 = 0.3$ とすれば、式(3.19)は次の式(3.20)に書き換えることができる.

$$r = e_c + a = 0.045 \cdot \sqrt[3]{\frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}} \cdot \sqrt[3]{W_c}$$
(3.20)

従って,光ファイバ光軸ZZ上のエァギャップ Z_c を消去するのに必要な,軸方向の所要接触力 W_c は,式(3.20)から次の式(3.21)で求めることができる.

$$W_c = \left(\frac{e_c + a}{0.045}\right)^3 \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2}$$
(3.21)

式(3.21)によれば、光ファイバ光軸 ZZ 上のエァギャップ Z_c を消去するために必要な軸方向の所要接触力 W_c は、各々テーパ・フェルールの斜め球面の接点 Q_c の光軸 ZZ からの偏心 e_c の3 乗に比例する.

式(3.21)により計算した,光ファイバ光軸上のエァギャップ Z_c を 消去するのに必要な,軸方向の所要接触力 W_c を図3.13示す.ただし, テーパ・フェルールの斜め球面の傾斜角度 θ_i が8度及び12度であると して,斜め球面の曲率半径 R_{I_i} , R_2 が,各々5 mm, 7.5 mm, 10 mm, 及び12.5 mmの場合について計算した.

図 3.13によれば、軸方向の所要接触力 W_c は、テーパ・フェルール の斜め球面の曲率半径 R_1 , R_2 の差異が大きいほど増加する。更に、所 要接触力 W_c は曲率半径値が大きいほど増加することが判る。1例とし て、斜め球面の傾斜角度 θ_1 が12度、一対のテーパ・フェルールの斜め 球面の曲率半径 R_1 , R_2 が、各々12.5 mmと12.5 mm,及び12.5 mm と5 mmの場合、この光ファイバ光軸上のエァギャップ Z_c を消去する のに必要な軸方向の所要接触力 W_c は、図3.13から、各々0 kgfと1.61 kgfであった. 同様に、斜め球面の傾斜角度 θ_1 が8度、一対のテーパ・フェルールの斜め球面の曲率半径 R_{I_1} , R_2 が、各々12.5 mmと12.5 mm、及び12.5 mmと5 mmの場合、軸方向の所要接触力 W_c は、各々 0 kgf と 0.58 kgfであった.

なお、この接触力はコネクタ・プラグに内臓した圧縮コイルばね力W。 により負荷される.従って、上述したように、FC/APCコネクタの 圧縮コイルばね力 W_o の実効値を0.7 kgfとすれば、 W_c が0.7 kgfよ り大きい領域では光ファイバ端面は密着しない.図3.13によれば、斜 め球面の傾斜角度 θ_1 が12度、テーパ・フェルール1の曲率半径 R_1 が 12.5 mmの場合、フェルール1と組合せるフェルール2の最小曲率半 径R,が6.5 mm以上でなければ、光ファイバ端面は密着しない.一方、 斜め球面の傾斜角度 θ, が 8 度の場合には、斜め球面の曲率半径 R, R, が,各々5mmから12.5mmの範囲の任意の組合せでも,所要接触 カWcは圧縮コイルばねカWoの実効値0.7 kgf以下であり、光ファイ バ端面は密着する. 斜め球面の傾斜角度 θ, が12度, テーパ・フェルー ル1の曲率半径 R,が12.5 mmの場合,フェルール1と組合せるフェ ルール2の最小曲率半径 R,は約7 mm以上でなければ、光ファイバ端 面は密着しない.一方,斜め球面の傾斜角度θ,が8度の場合は,フェル ール1と組合せるフェルール2の最小曲率半径 R。は約5.5 mm以上で なければ、光ファイバ端面は密着しない.

3.4 考察

以上に、テーパ・フェルールを使用して構成した従来のAPCコネク タについて、テーパ・フェルールの形状特性、及び接続特性について記 述した.これらの解析結果から、曲率半径 $R_{I,}$ R_2 及び接触力 W_c による 許容偏心量 $e_{c,}$ 光ファイバ端面のエアギャップ $Z_{c,}$ 及び斜め球面の接点 Q_c の光軸ZZに対する接触角度 ψ_c と反射戻り光による挿入損失につい て考察する.

3.4.1 斜め球面接点の許容偏心量



図 3.13 光ファイバ光軸上のエァギャップ Z_cを消去に必要 な軸方向の所要接触力 W_c

テーパ・フェルールの斜め球面の曲率半径 R_{I_1} R_2 及び接触力 W_c が変化した場合の,光ファイバ端面が密着できる許容偏心量 e_c は,式(3.20)を書き換えた次の式(3.23)により計算できる.



図 3.14 曲率半径 R₁, R₂ 及び接触力 W_cによる許容偏心量 e_c

$$e_{c} = 0.045 \cdot \sqrt[3]{\frac{R_{1} \cdot R_{2}}{R_{1} + R_{2}}} \cdot \sqrt[3]{W_{c}} - a$$
(3.22)

図 3.14は、式 (3.22) により計算したテーパ・フェルールの斜め球 面の曲率半径 $R_{1,}$ R_{2} ,及び圧縮コイルばね力 W_{0} により、光ファイバ端 面が密着できる許容偏心量 e_{c} を示す.ただし、斜め球面の傾斜角度 θ_{1} が 12 度、圧縮コイルばね力 W_{0} が、各々 0.5 kgf 及び 0.7 kgf、斜め 球面の曲率半径 $R_{1,}$ R_{2} が、各々 5 mm、7.5 mm、10 mm 及び 12.5 mm の場合について計算した.

図 3.14によれば、曲率半径 $R_{1,}$ R_{2} 及び接触力 W_{c} による許容偏心量 e_{c} は、テーパ・フェルールの斜め球面の曲率半径 R_{1} , R_{2} の差異が大き いほど、また、曲率半径値が小さいほど減少する.

3.4.2 光軸上のエアギャップによる挿入損失

APCコネクタにおいて、テーパ・フェルールの斜め球面に軸方向の 圧縮コイルばねカW_oを負荷し、一対のテーパ・フェルールの斜め球面 を相互に接続した場合、前述のように、接触力W_cが圧縮コイルばねカ W_oより大きい場合、光ファイバ端面間に生ずるエアギャップZ_cを消去 できない.例えば、斜め球面の傾斜角度 θ_1 が12度、テーパ・フェルール1の曲率半径 R_1 が12.5 mm、組合せるフェルール2の曲率半径 R_2 が6.5 mm以上の場合、図3.11から、このエアギャップ Z_c は約0.4 µm となり消去できない.この場合、第1章で記述したように、光ファイバ・コアと空気層との屈折率差によりフレネル損失、光ファイバ端面間の多重反射、及びエァギャップ Z_c による光の減衰などが総合されて挿入損失が大きくなる.次に、これらの要因による挿入損失の計算値を示す.

1) フレネル損失による挿入損失

光ファイバ1から空気層への出射光の透過率をT₁,空気層から光ファ イバ2への入射光の透過率をT₂とすれば、フレネル損失による挿入損 失 IL_rは次の式(3.23)で与えられる[17].

$$IL(dB) = -10\log(T_1 \times T_2) \tag{3.23}$$

ただし,

$$T_{1} = \frac{n_{0}\cos\theta_{0}}{2n_{1}\cos\theta_{1}} \left[\left(\frac{2n_{1}\cos\theta_{1}}{n_{1}\cos\theta_{1} + n_{0}\cos\theta_{0}} \right)^{2} + \left(\frac{2n_{1}\cos\theta_{1}}{n_{0}\cos\theta_{1} + n_{1}\cos\theta_{0}} \right)^{2} \right]$$
$$T_{2} = \frac{n_{1}\cos\theta_{1}}{2n_{0}\cos\theta_{0}} \left[\left(\frac{2n_{0}\cos\theta_{0}}{n_{0}\cos\theta_{0} + n_{1}\cos\theta_{1}} \right)^{2} + \left(\frac{2n_{0}\cos\theta_{0}}{n_{1}\cos\theta_{1} + n_{0}\cos\theta_{1}} \right)^{2} \right]$$

$$\theta_0 = \sin^{-1}(n_1 \sin \theta_1), \ \varphi = 0 \text{ degree}$$

ここで,

- θ_o: 光ファイバ1から空気層への光の出射角度,または,空
 気層から光ファイバ2への光の入射角度,
- θ₁:フェルール1及び2の端面の光軸ZZに直角な面に対する
 傾斜角度,
- n,:光ファイバ・コアの屈折率

n。:空気層の屈折率.

ここで、空気層の屈折率 $n_0=1$ 、光ファイバ・コアの屈折率 $n_1=1.47$

として式 (3.23) により挿入損失 *IL*を計算する. すなわち,フェルール 1 及び 2 の光軸 ZZ に直角な面に対する端面傾斜角度 θ_I が 12 度及び 8 度の場合,式 (3.23) により計算した挿入損失 *IL_F*は各々 0.38 dB及 び 0.34 dB になる. 従って,光ファイバ端面間にエアギャップ Z_c が生 じた場合,密着状態に比較して上述の挿入損失 *IL_F*が加算される.

2) 多重反射による挿入損失

更に, 光ファイバ端面間の多重反射による挿入損失 *IL_R*が加算される. この多重反射による挿入損失 *IL_R*は式(3.24)により与えられる[18].

$$IL_{A}(dB) = -10\log T\left[\frac{1}{1 + \left(\lambda \cdot z/2\pi \cdot n_{0} \cdot \omega_{0}\right)^{2}}\right]$$
(3.24)

ただし,

 $\delta = 4 \pi n_1 z / \lambda$:光束間の位相差,

λ:光波長,

a。:振幅,

 $r^{2} = |(n_{1}-1)/(n_{1}+1)|^{2}$:光の反射率.

接続端面が光軸に対して直角の光ファイバの端面間にエァギャップ Z_cがある状態で接続された場合,光波長λのλ/4に相当するエァ ギャップ毎に最大で約0.6 dBの挿入損失 IL_Rを生ずる.

3) エァギャップによる光減衰

第1章で記述したように,光ファイバ端面間の距離に応じて,光ファイバ量が減衰する.この光量の減衰による挿入損失*IL*Aは次の式(3.25)により計算できる[19],[20].

$$IL_{A}(dB) = -10\log T\left\{ \left[\frac{1}{1 + (\lambda \cdot z/2\pi \cdot n_{0} \cdot \omega_{0})^{2}} \right] \cdot \exp\left[-\left(\frac{z \cdot \sin\theta_{0}}{\omega \sqrt{1 + (\lambda \cdot z/2\pi \cdot n_{0} \cdot \omega_{0})^{2}}} \right)^{2} \right] \right\}$$

$$(3.25)$$

ただし,

λ:光の波長

n_o:空気層の光屈折率 (≒1.0)

ω₀:光ファイバ端面におけるモードフィルド半径

 θ_o : 光軸に対する光ファイバ1の光出射角度

式 (3.25) により計算した光量の減衰による挿入損失 IL_A は、光ファ イバ端面の傾斜角度 θ_i が12度及び8度について、各々0.14 dB/ μ m、 0.09 dB/ μ m になる、ただし、エァギャップ Z_c の範囲は100 μ m 以 内とする、

ここで、図 3.13 (a)によれば、斜め球面の傾斜角度 θ_I が12度、テ -パ・フェルール1の曲率半径 R_I が12.5 mmの場合、光ファイバ端 面が密着できるテーパ・フェルール2の曲率半径 R_2 は6.7 mmになる。 ここで、テーパ・フェルール2の曲率半径 R_2 が5 mmのときのエァ ギャップ Z_c は、図 3.11 (a)から0.4 μ mになる。式(3.23)から式 (3.25)により計算した、このときのエァギャップ Z_c による挿入損失 は、各々 $IL_F \approx 0.38$ dB、 $IL_R \approx 0.076$ 、 $IL_A \approx 0.056$ dBになる。従っ て、これらを合算した挿入損失 IL は約0.51 dBになる。

更に,光コネクタの挿入損失の要因として,第1章で記述した光ファ イバ間の光軸ずれによる損失が加算される.従って,光コネクタにとっ ては,光ファイバ間のエァギャップの消去は重要な課題である.

3.5 まとめ

第3章では、APCコネクタの形状特性、及び接続特性に関する普遍 的な課題を明らかにするために、フェルール回転角度 $\varphi = 0$ 度におい て、テーパ・フェルールの端面傾斜角度 θ_1 、及び斜め球面の曲率半径 R_1 と R_2 をパラメータとして、次の項目について理論解析を行った.

(a) 斜め球面頂点 P_c の光軸 ZZ からの偏心 S_c

(b) 接続時の斜め球面の接点 Q_c の光軸 ZZ からの偏心 e_c

(c) 光ファイバ端面の接触角度 ψ_c

(d) 及び光ファイバ端面間に生ずるエァギャップZ。

(e) エァギャップ*Z*_cを消去するための所要接触力*W*_c

(f) エァギャップ*Z*cによる挿入損失*IL*

解析結果は次のように要約できる.

1) 斜め球面の傾斜角度 θ_i

APCコネクタにおいて、斜め球面頂点 P_c の光軸ZZに対する偏心 S_c 、接続時の各々フェルールの接点 Q_c の光軸ZZに対する偏心 e_c 、光ファイバ端面のエアギャップ Z_c 、及びエアギャップ Z_c を消去するためのフェルール端面の接触力 W_c は、いずれも斜め球面の傾斜角度 θ_i の関数として与えられる.

2) 斜め球面頂点 Pc の光軸 ZZ に対する偏心 Sc

フェルールの接点 Q_c の光軸ZZに対する偏心 e_c は偏心 S_c の1乗の関数,エアギャップ Z_c は偏心 S_c の2乗の関数,フェルール端面の接触力 W_c は偏心 S_c の3乗の関数で与えられる.

3) 斜め球面の曲率半径 R₁ と R₂の差異 -1

偏心 e_c ,エアギャップ Z_c ,及び接触力 W_c は、各々 $[R_1/(R_1+R_2)]$, [$(R_1+R_2)/2R_1 \cdot R_2$],及び[$(R_1+R_2)/R_1 \cdot R_2$]の関数である。斜め球面 頂点 P_c の光軸ZZに対する偏心 S_c のみが曲率半径Rの関数となる。

4) 斜め球面の曲率半径 R, と R, の差異-2

曲率半径 R₁と R₂に差異があるときは、曲率半径 R₁と R₂が同一の場 合に比較して、偏心 e_c、エアギャップ Z_c、及び接触力 W_cは各々増加 する.

曲率半径 $R_1 \ge R_2$ の減少に伴って、偏心 e_c 、エアギャップ Z_c 、及び 接触力 W_c は各々減少する.

5) 斜め球面の接点 Q_c の接触角度 ψ_c

斜め球面の接点 Q_c の接触角度 ψ_c は、斜め球面の傾斜角度 θ_1 ,及び斜め球面の曲率半径 $R_1 \ge R_2$ の関数である.また、 ψ_c の数値は常に θ_1 より小さい.

6) エァギャップ Z による挿入損失 L

エアギャップ Z_c が消去できない場合の挿入損失ILは、各々フレネル 損失 IL_F ,多重反射損失 IL_R ,及びエァギャップの大きさによる光ファ イバ減衰による損失 IL_A を合算したものになる.

以上の結論は、テーパ・フェルールを使用したAPCコネクタの基本 接続特性として普遍的なものであり、以下に本論文では、これを基本と して議論を進める.

第3章参考文献

- [1] M. Takahashi, "Experimental Considerations for APC Optical Connectors with Slanted Angle of 8 Degrees," Graduate School of Electronic Science and Technology of Shizuoka Univ., Vol.1-17. pp.89-95, 1996.
- [2] M. Takahashi, "Optical Fiber Connector", US Patent. No. 4,747,659. 1989.
- [3] M. Takahashi, "Optical Fiber Connecting Device," US Patent. No. 4,953,941.1990.
- [4] M. Takahashi, "Compatibility of Conventional-Ferrule with Step-Ferrule for Angled Convex Optical Connectors," Proc, 45th IEEE ECTC, pp. 406-412, (May, 1995)
- [5] M. Takahashi, "Novel Stepped ferrule for angled convex polished optical fiber connector," Proc, IEEE OFC' 95. San Diego, Vol. 8, pp. 184-185, (Feb, 1995)
- [6] M. Takahashi, "Compatibility for optical connectors with different slanted angles at their ferrule endfaces," Proc, IEEE CLEO / Pacific Rim'95. pp. 304. (July, 1995)
- [7] 高橋光雄, "斜め球面研磨光コネクタの接続端面角度差異による互換 性"日本電子部品信頼性センタ、RCJ 第4回電子デバイスの信頼 性シンポジューム、pp. 39 - 45, (11, 1995)
- [8] 杉田悦治,他, "斜めPC (APC)コネクタの互換性試験結果," 1995 信学春全大, C-289. 1995.
- [9] 平 淳司,他, "超低反射戻り光Angled-PCコネクタ," 1994 信 学春全大, C-204. 1994.
- [10] International Electrotechnical Commission, "INTERNATIONAL STANDARD IEC-874-14-XX. "DETAIL SPECIFICATION FOR FIBRE OPTIC CONNEC-TOR TYPE SC-APC TUNED 8 DEGREES FOR SINGLE MODE FIBRE TYPE," May be published by the end of 1997.
- [11] International Electrotechnical Commission, "INTERNATIONAL STANDARD IEC 60874-14-6, Part 14-6: Detail specification for fibre optic connector Type SC-APC 9° untuned terminated to single-mode fibre type B1," pp. 6, 1997.

- [12] M.Takahashi, "Improved Design of APC connector with Slanted Angle of 12 degrees for Dispersion Shifted Optical Fiber," IEEE, Journal of Lightwave Technology. (Accepted subject to minor revision, October, 1997. Assigned No. 3371).
- [13] "技術指導資料: FC Type Fiber Optic Connector 図面," NTT アドバンステクノロジー株式会社, 1986.
- [14] "技術指導資料: SC Type Fiber Optic Connector 図面," NTT アドバンステクノロジー株式会社, 1989.
- [15] M. Takahashi, "Elastic Polishing Plate Method and Conditions for Forming Angled Convex Surface on Ferrule Endface," IEEE Journal of Lightwave Technology. Vol. 15, No. 9, pp. 1675 - 1680, 1997.
- [16] 機械設計便覧編纂委員会, "機械設計便覧," 丸善株式会社. pp.1872, 1973.
- [17] New-Port Catalogue, New-Port Co., LTD. pp. J-23, 1990.
- [18] 鈴木,他, "光コネクタ損失特性の端面処理効果,"昭56年度信学 全大, No. 2256, 1981.
- [19] D. Marcuse, "Loss Analysis of Single-Mode Fiber Splices," Bell System Tech' Journal, Vol. 56, No. 5, p. 713, 1977.
- [20] M. Takahashi, "Variable Light Attenuator of Improved Air-gap Type with Extremely Low Returning Light," Proc, IEEE IMTC/94, Vol. 2, pp. 947-950, (May. 1994).

第4章 テーパ・フェルール付きAPCコネクタの解析-2

フェルール回転角度 $\varphi \ge 0$ 度における接続特性

4.1 まえがき

APCコネクタでは、各光コネクタ部品間の整列キーと整列キー溝と の間の隙間により、フェルールが相互に円周方向に若干回転した状態で 接続されることが考えられる.この場合、各フェルールの斜め球面はV 字形状に開くので、光ファイバ端面間に過大なエァギャップが生じ、挿 入損失を増大させて接続の互換性を阻害する.従って、APCコネクタ の接続を論ずる上でこの接続時のフェルール間の回転は非常に重要であ る[1].

図4.1(a),(b)に,光コネクタ部品間の整列キーと整列キー溝との間の 隙間の関係を説明するための光コネクタの断面を示す.図4.1(a),(b) は,各々FC型コネクタ及びSC型コネクタを示す.表4.1は,これら の光コネクタ部品間の整列キーと整列キー溝の隙間の寸法諸元の一例を 示す[2],[3].図4.1及び表4.1から,FC型コネクタ部品間の整列キー と整列キー溝との間の隙間によるフェルールの回転角度 φは,相互の フェルールについて最大で約16度に達する.一方,SC型コネクタ部 品間では最大で14.7度に達する.しかし,経験的に,実際の接続状態 における一対のフェルール間の相互間の回転角度は平均して,これらの 値より小さいものと推定される.従って,本論文では,フェルール回転 角度の範囲は10度以内と仮定して論ずる.

フェルールが回転して接続された場合を含め,APCコネクタの形状 特性,及び接続特性に関する文献等は少ない[4]-[14].従って,第4章 では,第3章で基本的な形状特性,及び接続特性について理論解析を 行ったテーパ・フェルール,及び図4.1と表4.1に示す従来のPCコネ クタ用部品を使用して構成したAPCコネクタについて,形状特性及び 接続特性について理論解析をする.ここで,理論解析では,テーパ・フェ ルールの端面傾斜角度θ₁が各々8度と12度,斜め球面の曲率半径R₁,R₂ が,各々5mmから12mmの範囲,及びテーパ・フェルールの回転



(a). Schematic section of FC connector components.

(b). Schematic section of SC connector components.

図4.1 FC型及びSC型コネクタの接続時の断面

角度 φが0~10 度の範囲について取り扱う.また,第4章では,これ らの解析結果にもとずいて,フェルール回転によるAPCコネクタの接 続特性の改善課題を明らかにする.

4.2 フェルール回転による形状特性の理論解析

4.2.1 フェルール回転による接続状態の概要

最初に,フェルール回転に起因する接続状態の変化の概要を明らかに する必要がある.そこで,テーパ・フェルール2のテーパ・フェルール 1に対する回転角度が,各々 $\varphi = 0$ 度及び $\varphi = 90$ 度の場合の接続端面 状態を,各々図 4.2 (a),(b)に示す.

図 4.2 において、テーパ・フェルール1とテーパ・フェルール2の斜め球面の傾斜角度 θ_1 、 θ_1 、及び曲率半径 R_1 、 R_2 は、各々同一の値である。図 4.2 (a)は、フェルール回転角度 φ =0度について示したものである。図 4.2 (a)において、 P_{c1} 、 P_{c2} は各々斜め球面の頂点、 O_1 及び O_2 は、テーパ・フェルール1及び2の球面曲率半径 R_1 及び R_2 の中心点、 Q_c は斜め球面の接点、 e_{cy} は斜め球面の接点Q_cの光軸ZZからの偏心のуу 座標を示す。この場合、各フェルールの斜め球面は球体の表面の一

表 4.1 FC型,及びSC型コネクタにおける整列キーと 整列キー溝とによる隙間の寸法諸元の一例.

Locations of key		Dimensions	Rotation angle
and key-slit		(mm)	(degrees)
Ferrule key-slit	: W1	1.50	
Holder key	: W2	1.00	Up to 13.0
Adaptor key-slit	: W3	2.20	
Plug key	: W4	2.00	Up to 3.2
Total rotation angle : φ			Up to 16.2

(a). FC connector components.

Locations of key		Rotation angle
and key-slit		(degrees)
: W1	1.50	
: W2	1.20	Up to 8.0
: W3	5.70	
: W4	5.50	Up to 4.2
: W5	9.10	
: W6	8.90	Up to 2.5
Total rotation angle : φ		Up to 14.7
	f key : W1 : W2 : W3 : W4 : W5 : W6 ngle : <i>q</i>	f key Dimensions (mm) : W1 1.50 : W2 1.20 : W3 5.70 : W4 5.50 : W5 9.10 : W6 8.90 ngle : φ

(b). SC connector components.

部であると考えられるので、各斜め球面の接点Q_cは常に中心点O₁及び O₂を結ぶ線 分L上にある.この線分Lは曲率半径R₁, R₂の和で与え られるので一定値である. H_{c1} 及び H_{c2} は、各々テーパ・フェルール1 及び2の曲率半径の中心点O₁及びO₂の光ファイバ光軸ZZからの距離 を示す.テーパ・フェルール2の斜め球面の頂点P_{c2}と曲率半径R₂の中 心点O₂とを結ぶ線分上に点O_pは存在し、点O_pは線分P_{c2}O_pと光軸ZZ との交点である.テーパ・フェルール2の曲率半径R₂の中心点O₂は、 この交点O_pを回転中心とし、回転半径 H_{c2} の円上を移動する.テーパ・ フェルール1と2の曲率半径R₁, R₂が同一の場合、曲率半径R₁, R₂の 中心点O₁, O₂は光軸ZZに対して対称であって、等距離 H_{c1} , H_{c2} に位 置する. $H_{c1} = H_{c2}$ であるため、斜め球面の接点Q_cは光軸ZZ上に位置 するので、斜め球面の接点Q_cの光軸ZZからの偏心 e_{cy} は零になる. 図4.2 (b) は、テーパ・フェルール2の回転角度が φ =90度につい


する回転角度による端面の接続状態

て示したものである. この場合, テーパ・フェルール2の曲率半径 R_2 の中心点 O_2 は, 光軸ZZに一致する. 従って, 中心点 O_1 , O_2 の光軸ZZ からの距離 H_{c1} , H_{c2} の関係は, $H_{c1} > H_{c2}$ である. このため, 斜め球面 の接点 Q_c は, yy座標上で光軸ZZから偏心 e_{cy} を生ずる. 同時に, xx 座標成分Xにより, 斜め球面球面 Q_c はxx座標上でも偏心 e_{cx} を生ずる.

端面を斜め球面研磨したAPCコネクタ用フェルールの一方を,回転 角度 $\varphi < 90$ 度の範囲で回転させた場合,斜め球面の接点 Q_cの光軸 ZZ からの偏心は,yy 軸座標成分の e_{cy} ,及び xx 軸座標成分の e_{cx} の複合 成分として与えられる.同時に,斜め球面の接点 Q_cの光軸 ZZ に対する 傾斜角度 は,フェルール回転角度が $\varphi = 0$ 度において最大となり, φ = 90 度において最小になる.

4.2.2 斜め球面の接点の光軸からの偏心





(b). Shift e_{cx} of contacting point Q_c on abscissa xx.

図 4.3 テーパ・フェルール 2 の回転に起因する端面接点 Q_cの光 軸 ZZ からの偏心 e_{cv} 及び e_{cx}.

図 4.3 (a),(b) は、各テーパ・フェルールの斜め球面の傾斜角度 θ_1, θ_2 ,及び曲率半径 R_1 , R_2 を各々同一とし、各々yy軸及びxx軸につ いて、斜め球面の接点Q_cの光軸ZZからの偏心 e_c を求めたものである. 図 4.3 (a),(b)においては、APCコネクタのフェルール2を、回転角 度 φ < 90 度の範囲で回転させたと仮定している.図 4.3 (a)は、斜め 球面の接点Q_cの光軸ZZからの偏心のyy軸座標 e_{cy} を求める解析図で ある.図 4.3 (b)は、斜め球面の接点Q_cの光軸ZZからの偏心のxx軸 座標 e_{cx} を求める解析図である。図 4.3 に使用した各記号は、図 4.2 で 説明したものと同一である.ここで、 ψ_{cy}, ψ_{cx} は、各々yy座標及びxx 座標における斜め球面の接点 Q_cの光軸 ZZ に対する接触角度を示す. 各々の理論式は、次のよう表わされる.

1) 斜め球面接点 Q_cの光軸 ZZ に対する偏心の yy 座標 e_c

図4.3 (a)において, テーパ・フェルール1を固定して, テーパ・フェ ルール2をを, 回転角度 φ < 90度の範囲で回転させたと仮定する. こ の場合,前述のように, テーパ・フェルール2の曲率半径 R_2 の中心点 O₂は,斜め球面の頂点P_{c2}と曲率半径 R_2 の中心点O₂を結ぶ線分P_{c2}O₂ と光軸ZZとの交点O_pを回転中心,光軸ZZを回転軸として,回転半径 H_{c2} の円軌跡に沿って回転する. 従って,回転角度 φ におけるテーパ・ フェルール2の斜め球面の頂点 P_{c2} の光軸ZZからの偏心を S_{c2} 'とすれ ば, S_{c2} 'は式 (4.1)より求められる.

$$S_{c2} = S_{c2} \cos \varphi \tag{4.1}$$

回転角度 φ において,曲率半径 R_2 の中心点 O_2 の光軸ZZからの距離 E_{c2} 'とすれば, H_{c2} 'は式(4.2)により求められる.

$$H_{c2}' = H_{c2} \cdot \cos\varphi \tag{4.2}$$

回転角度jにおいて、テーパ・フェルール2の斜め球面の傾斜角度 θ_{1} 'とすれば、 θ_{1} 'は式(4.3)より求められる.

 $\theta_1' = \tan^{-1} \left(\tan \theta_1 \cdot \cos \varphi \right) \tag{4.3}$

テーパ・フェルール2の斜め球面上の接点 Q_c のyy座標における光軸 ZZからの偏心 e_{cy} は,各々の曲率半径 R_1 , R_2 の中心点 O_1 , O_2 の光軸 ZZからの距離 H_{c1} , H_{c2} 'の合計値($H_{c1} + H_{c2}$ ')を,各テーパ・フェルー ルの斜め球面の曲率半径 R_1 , R_2 の比率で分割した位置にある.従って, テーパ・フェルール2の斜め球面の接点 Q_c のyy座標における偏心 e_{cy} は、次の式(4.4)より求めることができる.

$$e_{Cy} = \frac{1}{\cos\psi_{Cy}} \left[\frac{R_1 \left(|H_{C1}| + H_{C2} \right)}{R_1 + R_2} - |H_{C1}| \right]$$
(4.4)

ここで、テーパ・フェルール1の曲率半径 R_1 の中心点 O_1 の光軸ZZ からの距離 H_{c1} は、図 3.6 及び図 4.3 から求めることができ、式 (4.5) により与えられる.

$$H_{c_1} = R_1 \sin \theta_1 - S_{c_1} \cos \theta_1$$

(4.5)

同様にして、テーパ・フェルール2の曲率半径 R_2 の中心点 O_2 の光軸 ZZ からの距離 H_{c2} は、式(4.6)により与えられる.

$$H_{c2}' = (R_2 \sin \theta_1 - S_{c2} \cos \theta_1) \cos \varphi \tag{4.6}$$

従って,式(4.4)に式(4.5)及び式(4.6)を代入すれば,式(4.4)は, 次の式(4.7)のようになる.

$$e_{Cy} = \frac{R_1 \Big[\left| R_1 \sin \theta_1 - S_{C1} \cos \theta_1 \right| + \left(R_2 \sin \theta_1 - S_{C2} \cos \theta_1 \right) \cos \varphi \Big]}{\left(R_1 + R_2 \right) \cos \psi_{Cy}}$$

$$-\frac{\left|R_{1}\sin\theta_{1}-S_{c1}\cos\theta_{1}\right|}{\cos\psi_{C_{1}}}$$

$$=\frac{R_{1}(R_{2}\sin\theta_{1}-S_{C2}\cos\theta_{1})\cos\varphi-R_{2}|R_{1}\sin\theta_{1}-S_{C1}\cos\theta_{1}|}{(R_{1}+R_{2})\cos\psi_{Cy}}$$
(4.7)

2) 斜め球面接点 Q_c の光軸 ZZ に対する zz-yy 平面上での傾斜角度 ψ_{cy}

式 (4.4), (4.7) において, ψ_{cy} は, 斜め球面の接点 Q_c の光軸ZZ に 対するzz-yy平面上での傾斜角度であり, 図4.3から式 (4.8)より求め ることができる.

$$\psi_{Cy} = \sin^{-1} \left(\frac{|H_{C1}| + H_{C2}'}{R_1 + R_2} \right)$$

= $\sin^{-1} \left[\frac{|R_1 \sin \theta_1 - S_{C1} \cos \theta_1| + (R_2 \sin \theta_1 - S_{C2} \cos \theta_1) \cos \varphi}{R_1 + R_2} \right]$ (4.8)

以上の式(4.1)~(4.8)より,斜め球面接点Qcの光軸ZZに対す

る yy 座標の偏心 e_{cy} ,及び斜め球面接点 Q_c の光軸 ZZ に対する zz-yy 平面上での傾斜角度 ψ_{cy} を計算できる.

3) 斜め球面接点 Q_c の光軸 ZZ に対する偏心の xx 座標 e_{cx}

図 4.3 (b) において, テーパ・フェルール2が角度 φ だけ回転した 場合の, 斜め球面接点 Q_c のxx座標を X_c として表わせば, X_c は式 (4.9) より求めることができる.

$$X_c = H_{c2} \cdot \sin\varphi \tag{4.9}$$

斜め球面接点Q_cの光軸ZZに対する偏心のxx座標*e_{cx}は*,式(4.10) により求めることができる.

$$e_{CX} = \frac{R_1 \cdot H_{C2} \cdot \sin \varphi}{(R_1 + R_2) \cos \psi_{CX}}$$
(4.10)

4) 斜め球面接点 Q_c の光軸 ZZ に対する zz-yy 平面上での傾斜角度 ψ_{cx}

斜め球面接点 Q_c の光軸 ZZ に対する zz-yy 平面上での傾斜角度 ψ_{cx} は,式(4.11)で求めることができる.

 $\psi_{CX} = \tan^{-1} \left[\frac{H_{C2} \cdot \sin \varphi}{(R_1 + R_2) \cos \psi_{Cy}} \right]$ (4.11)

5) 斜め球面接点 Q_c の光軸 ZZ に対する偏心 e_c

図 4.4 (a), (b) は, テーパ・フェルール1 とテーパ・フェルール2の 斜め球面の曲率半径 R_1 , R_2 が同一である場合,及び異なる場合につい て,偏心 e_c 及び斜め球面の接点 Q_c の軌跡を示す.フェルール2の回転 角度が φ において,偏心 e_c は,各々 yy 座標および xx 座標の斜め球面 接点 Q_c の光軸 ZZ に対する偏心 e_{cy} 及び e_{cx} を総合したものである.斜 め球面の接点 Q_c は,回転角度 φ によって移動する.図 4.4 (a), (b) は, 図 4.3 の偏心を光軸 ZZ 方向から見た x, y 座標図である.

図 4.4 (a) は、フェルール1と2の斜め球面の曲率半径 R_1 , R_2 が同 一の場合について示したものである. 斜め球面接点 Q_c の光軸ZZに対す る偏心 e_c は、テーパ・フェルール1の斜め球面の曲率半径 R_1 の中心 O_1



図 4.4 斜め球面の接点 Q_c の光軸 ZZ に対する偏心 e_c と移動軌跡

と、テーパ・フェルール2の斜め球面の曲率半径 R_2 の中心O₂とを結ぶ 線分L上にある.更に、yy座標およびxx座標での斜め球面接点Q_cの 光軸ZZに対する偏心 e_{cy} 及び e_{cx} のベクトル和を表わす点Q_cは、O₁と O₂を結ぶ線分L上にある.従って、斜め球面接点Q_cの光軸ZZに対す る偏心 e_c は式(4.12)により求めることができる.

 $e_{c} = \sqrt{e_{cx}^{2} + e_{cy}^{2}} \tag{4.12}$

6) 角度 φによる斜め球面接点 Q の移動を表わす軌跡

回転角度 φ の増加に伴う斜め球面接点 Q_c の移動を表わす軌跡 L_1 のxy 座標は,式(4.4)及び(4.10)から計算できる.図4.4では,移動軌 跡 L_1 の形状は円になる.この移動軌跡円 L_1 の半径 L_R は式(4.13)に より求めることができる.

$$L_{R} = \frac{1}{2} \left\{ \left| H_{C1} \right| - \left[\frac{\left| H_{C1} \right| \left(\left| H_{C1} \right| - H_{C2} \right)}{\left| H_{C1} \right| - H_{C2}} + e_{Cy'} \right] \right\}$$

$$=\frac{2|H_{c1}| \cdot H_{c2} - (|H_{c1}| + H_{c2}) e_{cy'}}{2(|H_{c1}| + H_{c2})}$$
(4.13)

ただし、 e_{cv} 'は回転角度 $\varphi = 0$ 度における偏心である.

曲率半径 R_1 , R_2 が同一の場合,線分 ZO_1 と線分 ZO_2 とは等しくなる から,角度 φ の増加による接点 Q_c の移動軌跡 L_{xy} は,半径 L_R が(H_{c1} / 2)の正円になる.これは,図4.4及び式(4.13)から理解できる. 方,図4.4 (b)に示すように曲率半径 R_1 , R_2 が $R_1 > R_2$ と異なる場合 には,回転角度 φ =0度について図3.8に示したような偏心 e_{cy} 、が生じ ている.従って,曲率半径 R_1 , R_2 が同一の場合に比較して,同一回転 角度 φ における偏心 e_c は大きくなる.この場合,接点 Q_c の移動軌跡円 L_1 の半径 L_R は式(4.13)で示される.

7) 回転角度 φ に対応する斜め球面接点 Q_cの光軸 ZZ に対する傾斜角度 ψ_c
 図 4.4 から,斜め球面接点 Q_cの光軸 ZZ に対する傾斜角度 ψ_cは,式
 (4.14) により求めることができる.

$$\psi_{c} = \sin^{-1} \left[\frac{\sqrt{\left(\left| H_{c1} \right| + H_{c2} \cdot \cos \varphi \right)^{2} + \left(H_{c2} \cdot \sin \varphi \right)^{2}}}{R_{1} + R_{2}} \right]$$
(4.14)

従って、回転角度 $\varphi = 0$ 度の場合、式(4.15)により傾斜角度 ψ_c を求めることができる.

$$\psi_{c} = \sin^{-1} \left[\frac{\sqrt{\left(\left| H_{c1} \right| + H_{c2} \cdot \cos \varphi \right)^{2}}}{R_{1} + R_{2}} \right]$$
(4.15)

回転角度 $\varphi = 90$ 度の場合,式(4.16)により傾斜角度 ψ_c を求めることができる.

$$\psi_{c} = \sin^{-1} \left[\frac{\sqrt{|H_{c1}|^{2} + (H_{c2} \cdot \sin\varphi)^{2}}}{R_{1} + R_{2}} \right]$$
(4.16)

この場合,式(4.16)は第3章の式(3.14)と同じ式になる.

図 4.5 から図 4.7 に、斜め球面の傾斜角度 θ_1 が 12 度及び 8 度のテーパ・フェルールについて、フェルールの回転による斜め球面の接点 Q_c の光軸に対する偏心 e_c を示す。各々の図の偏心 e_c は以上の理論解析による計算式により求めたものである、

一対のテーパ・フェルールの斜め球面の曲率半径 R₁, R₂の組合せが, 各々 12.5 mm と 12.5 mm, 12.5 mm と 10 mm, 12.5 mm と 7.5 mm, 及び 12.5 mm と 5 mm の場合について, テーパ・フェルール 2 の回転角度 φを 0 度から 10 度まで 2 度おきに変えたときの値を図 4.5 に示す.

ー対のテーパ・フェルールの斜め球面の曲率半径 R_{I_1} R_2 の組合せが, 各々10 mm と10 mm, 10 mm と7.5 mm, 及び10 mm と5 mm の場合について,テーパ・フェルール2の回転角度 φ を0度から10度 まで2度おきに変えたときの値を計算した,フェルールの回転に伴う斜 め球面の接点 Q_c の光軸に対する偏心 e_c を図 4.6 に示す.

ー対のテーパ・フェルールの斜め球面の曲率半径 R_{I_1} R_2 の組合せが, 各々7.5 mmと7.5 mm,及び7.5 mmと5 mm,並びに,5 mmと 5 mmの場合について,テーパ・フェルール2の回転角度 φ を0度から 10 度まで2 度おきに変えたときのの値を計算した,フェルールの回転 に伴う斜め球面の接点 Q_c の光軸に対する偏心 e_c の値を図4.7に示す.

図 4.5 ~ 図 4.7 から、フェルール回転に起因する、斜め球面接点 Q_c の光軸 ZZ に対する偏心 e_c は、フェルール回転角度 φ 、斜め球面の傾斜角度 θ_1 、及びテーパ・フェルールの斜め球面の曲率半径 R_1 、 R_2 の差異に依存することが判る。更に、曲率半径 R_1 、 R_2 が同一の値の組合せの接続では、偏心 e_c は、フェルールの回転角度 φ にほぼ比例して増加する。一方、曲率半径 R_1 、 R_2 に差異がある組合せの接続では、フェルール回転角度 φ が6~8度以下の範囲においては、yy座標上の偏心 e_{cy} の影響を受けて、フェルール回転角度 φ に直線的には比例しない。

1例として、図 4.5 及び図 4.7 において、フェルール回転角度 $\varphi = 6$ 度と仮定する. そこで、斜め球面の傾斜角度 θ_1 が12度、一対のテーパ・



図 4.5 フェルールの回転による斜め球面の接点 Q_cの光軸 に対する偏心 e_c

フェルールの斜め球面の曲率半径 $R_{1,} R_{2}$ が,各々12.5 mmと12.5 mm,12.5 mmと5 mm,及び5 mmと5 mmの場合,偏心 e_{c} は,各々128 μ m,100 μ m及び45 μ mになった.同様に,斜め球面の傾斜角度 θ_{1} が8度の場合,偏心 e_{c} は,各々86 μ m,68 μ m及び31

<第4章>



に対する偏心e。

μm になった.

4.2.3 斜め球面の接点の光軸に対する接触角度

フェルール回転に起因する、斜め球面上の接点 Q_c の光軸 ZZ に対する接触角度 ψ_c を、式(4.14)により計算して図 4.8に示す.ここでは、



図 4.7 フェルールの回転による斜め球面の接点 Q_cの光軸 ZZ に対する偏心 e_c

斜め球面の傾斜角度 θ_1 が,各々12度及び8度,一対のテーパ・フェルールの斜め球面の曲率半径 R_1 , R_2 の組合せが,各々12.5 mmと12.5 mm, 12.5 mmと5 mm,及び5 mmと5 mmの場合について,テーパ・フェルール2の回転角度 φ を0度から10度まで2度おきに変えて値を計算した.

<第4章>





この斜め球面の接点 Q_c の光軸 ZZ に対する接触角度 ψ_c は,一般に, 斜め球面の傾斜角度 θ_1 ,及びテーパ・フェルールの斜め球面の曲率半径 R_1 , R_2 の差異に依存する.しかし、フェルール回転角度 φ が10 度の範 囲では、フェルールの回転による影響は殆ど受けないことが図4.8から 判る.更に、曲率半径 R_1 , R_2 の差異が大きい組合せの接続では、接触 角度 ψ_c は小さな値になることが図 4.8 から判る. 斜め球面の傾斜角度 θ_1 が12度,一対のテーパ・フェルールの斜め球面の曲率半径 R_{I_r} R_2 の 組合せが,各々12.5 mm と12.5 mm, 12.5 mm と5.0 mm,及び 5,0 mm と5.0 mm であると仮定する. この場合,フェルールの回転 角度 φ が,各々0度及び10度における接触角度 ψ_c の差異は,図4.8 に よれば,いずれも0.05度以下であった.

4.2.4 光ファイバ端面の光軸上のエァギャップ

フェルール回転によるエァギャップ*Z*cは,式(3.18)によって得ら れた次の式(4.17)で求めることができる.

(4.17)

$$Z_c \simeq (R_1 + R_2) e_c^2 / 2R_1 \cdot R_2$$

図4.9は,式(4.17)により計算した,接触圧力が零の時の光ファイ パ光軸ZZ上のエァギャップ Z_c である.ただし,斜め球面の傾斜角度 θ_1 が,各々8度及び12度,一対のテーパ・フェルールの斜め球面の曲率 半径 R_{I_1} , R_2 の組合せが,各々12.5 mmと12.5 mm,12.5 mmと5 mm,及び5 mmと5 mmの場合について,テーパ・フェルール2の 回転角度 φ を0度から10度まで2度おきに変えたときの値を計算した. フェルールの回転による接触圧力が零の時,光ファイバ光軸ZZ上の エァギャップ Z_c は,フェルールの回転角度 φ ,斜め球面の傾斜角度 θ_1 , 及びテーパ・フェルールの斜め球面の曲率半径 R_1 , R_2 の差異に依存す ることが図4.9から判る.更に,曲率半径 R_1 , R_2 が同一の値のときの 組合せの接続では,このエァギャップ Z_c は,フェルールの回転角度 φ が 0度の時には各々零になる.しかし,エァギャップ Z_c の増加は曲率半 径 R_1 , R_2 が小さいほど小さい.一方,曲率半径 R_1 , R_2 に差異がある組 合せの接続では,フェルールの回転角度 φ が0度のときでも,yy座標 上の偏心 e_{cv} の影響を受けてエァギャップ Z_c は零にはならない.

1例として、フェルールの回転角度 φ が6度であると仮定する.この とき、斜め球面の傾斜角度 θ_1 が12度、一対のテーパ・フェルールの斜 め球面の曲率半径 R_{I_1} , R_2 が、各々12.5 mm と12.5 mm、12.5 mm と5 mm、及び5 mm と5 mmの場合、図4.7 では、エァギャップ Z_c

<第4章>



図 4.9 テーパ・フェルール回転角度による接触圧力ゼロの時 の光ファイバ光軸 ZZ 上のエァギャップ Z_c

は、各々128 μ m, 100 μ m 及び45 μ m になった。同様に、斜め球 面の傾斜角度 θ_1 が8度の場合、エァギャップ Z_c は、各々0.59 μ m, 0.64 μ m 及び0.21 μ m であった。

4.3 フェルールの回転による接続特性の変化の理論解析

第4.3項では,第4.2項で仮定した形状特性をもっているテーパ・フェ ルールを使用して構成したAPCコネクタについて,光ファイバ端面間 のエァギャップ*Z*_cを消去するために要する軸方向の接触力について記 述する.

曲率半径 R₁及び R₂の2個の中実球面を接触させて,接触力 W_cで接触点を押した場合,球面の弾性変形により生ずる円形平面の半径 r は,式(3.19)に引用した Hertz の弾性方程式により与えられる [15].

ここで、各テーパ・フェルールの材質をジルコニア・セラミックとして、ヤング率 $E_1 = E_2 = 15,000 \text{ kgf/mm}^2$ 、ポアソン比 $v_1 = v_2 = 0.3$ とする.

エァギャップ*Z_c*を消去するのに必要な,軸方向の所要接触力*W_c*は, 式(4.18)で求めることができる.

$$W_{c} = \left(\frac{e_{c} + a}{0.045}\right)^{3} \cdot \frac{R_{1} + R_{2}}{R_{1} \cdot R_{2}}$$
(4.18)

斜め球面の傾斜角度 θ_1 が,各々12度及び8度のテーパ・フェルール について,式(4.18)により計算した光ファイバ光軸上のエァギャップ Z_c を消去するのに必要な,軸方向の所要接触力 W_c を図4.10から図 4.12に示す.

ー対のテーパ・フェルールの斜め球面の曲率半径 $R_{I_{i}}$, R_{2} の組合せが, 各々12.5 mmと12.5 mm, 12.5 mmと10 mm, 12.5 mmと7.5 mm,及び12.5 mmと5 mmの場合について,テーパ・フェルール2 の回転角度 φ を0度から10度まで2度おきに変化させたときの値を図 4.10に示す. グレイの塗色部分は,光コネクタ・プラグに内蔵された コイルばね力 W_{0} を0.7 kgfと仮定したときに,光ファイバ端面の密着 できる領域を示す.

図 4.10 において、斜め球面の傾斜角度 θ_1 が 12 度の場合、一対のテ - パ・フェルールの斜め球面の曲率半径 R_{I_r} R_2 の組合せが、各々 12.5 mm と 5 mm のときには、所要接触力 W_c は最低でも 1.7 kgf を要す る. 従って、コイルばね力 W_o を 0.7 kgf とすれば、光ファイバ端面は

<第4章>



図 4.10 テーパ・フェルールの回転角度による光ファイバ 光 軸 ZZ 上のエァギャップ Z_cを消去するための所要接 触力 W_c

密着しないことが判る. その他の曲率半径 $R_{I_1}R_2$ の組合せでは, テーパ・ フェルール2の回転角度 φ が約3度以下の範囲では, 光ファイバ端面は 密着できる. 一方, 斜め球面の傾斜角度 θ_1 が8度の場合, 一対のテーパ・ フェルールの斜め球面の曲率半径 $R_{I_1}R_2$ の組合せが, 各々12.5 mmと



図 4.11 テーパ・フェルールの回転角度による光ファイバ 光 軸 ZZ 上のエァギャップ Z_cを消去するための所要接 触力 W_c

5.0 mmのときには、テーパ・フェルール2の回転角度 φが約4度以下 の範囲では、光ファイバ端面は密着できる.その他の曲率半径 R₁, R₂の 組合せの場合は、テーパ・フェルール2の回転角度 φが約5度以下の範 囲では、光ファイバ端面は密着できる.



図 4.12 テーパ・フェルールの回転角度による光ファイバ 光 軸 ZZ 上のエァギャップ Z_cを消去するための所要接 触力 W_c

ー対のテーパ・フェルールの斜め球面の曲率半径 R_{I_1} , R_2 の組合せが, 各々10 mmと10 mm, 10 mmと7.5 mm, 及び10 mmと5 mm の場合について,テーパ・フェルール2の回転角度 φ を0度から10度 まで2度おきに変えたときの値を図4.11に示す. 一対のテーパ・フェルールの斜め球面の曲率半径 R_{I_1} , R_2 の組合せが, 各々7.5 mmと7.5 mm,及び7.5 mmと5.0 mm,並びに, 5.0 mm と5.0 mmの場合について,テーパ・フェルール2の回転角度 φ を0度 から10度まで2度おきに変えたときの値を図4.12に示す,

図4.10~図4.12によれば、テーパ・フェルール2の回転角度 φの増加に伴って、軸方向の所要接触力 W_cは急激に増大する.更に、斜め球面の曲率半径 R₁, R₂の差異が大きいほど、また、曲率半径が大きいほど軸方向の所要接触力 W_cは増加する.

4.4 考察

ここでは、テーパ・フェルールの接続時の許容回転角度 *φ*、テーパ・フェルールの回転に起因する斜め球面の接点 Q_cの偏心 *e_c*、斜め球面の接点Q_cの光軸ZZに対する接触角度*ψ_c*、及びフェルール回転によるフェルール2の斜め球面の傾斜角度の変化に起因する挿入損失について考察する.

4.4.1 テーパ・フェルールの接続時の許容回転角度

以上に、テーパ・フェルールを使用して構成したAPCコネクタについて、テーパ・フェルールが回転した場合のテーパ・フェルールの接続端面の形状特性、及び接続特性について記述した.これらの解析結果から、特に、光ファイバ端面間のエァギャップ Z_cを消去するための所要接触力 W_cは、接続時のテーパ・フェルールの回転角度 φにより大きな影響を受けることがわかった.よって、テーパ・フェルールの接続時の許容回転角度について次に考察する.

各々斜め球面の傾斜角度 θ_1 が12度及び8度のとき,テーパ・フェルー ル1及びテーパ・フェルール2の斜め球面の曲率半径 $R_{1,}R_2$ が変化した 場合について,光ファイバ端面間のエァギャップ Z_c を消去できるテー パ・フェルールの許容回転角度 φ を図4.10~図4.12から求めた.これ らの値を表4.2に示す.ここでは,光コネクタのコイルばねカ $W_0 = 0.7$ kgf と仮定した.

表4.2によれば、斜め球面の傾斜角度θ,が12度の場合、全ての斜め

Convex radius R_1 and R_2 (mm)	Slanted angle $\theta_1 = 12$ degrees	Slanted angle $\theta_I = 8$ degrees
12.5 and 12.5 12.5 and 10.0 12.5 and 7.5 12.5 and 5.0 10.0 and 10.0 10.0 and 7.5 10.0 and 5.0	< 3.3° < 3.4° < 3.5° None < 3.9° < 4.2° None	$< 5.0^{\circ} < 5.3^{\circ} < 5.7^{\circ} < 4.2^{\circ} < 5.0^{\circ} < 5.2^{\circ} < 5.7^{\circ}$
7.5 and 7.5 7.5 and 5.0 5.0 and 5.0	$<\!$	$< 7.2^{\circ} < 6.9^{\circ} < 9.4^{\circ}$

図 4.2 光ファイバ 端面を密着できるテーパ・フェルール の許容回転角度 *φ*

球面の曲率半径 R_{I_1} , R_2 の組合せについて,光ファイバ端面間のエァ ギャップ Z_c を消去することができると言うわけではない.特に,斜め 球面の曲率半径 R_{I_1} , R_2 の組合せが,各々12.5 mmと5 mm及び10 mm と5 mmのときには,回転角度 φ が零であっても,光ファイバ端面間の エァギャップ Z_c を消去するための所要接触力 W_c はコイルばねの有効接 触力 $W_0 = 0.7$ kgf より大きくなり,光ファイバ端面間のエァギャッ プ Z_c を消去することができない.一方,斜め球面の傾斜角度 θ_1 が8度 の場合,全ての斜め球面の曲率半径 R_{I_1} , R_2 の組合せについて,回転角度 φ が約5度以下であれば,光ファイバ端面間のエァギャップ Z_c を消去す ることができる.

更に,表4.2によれば,斜め球面の曲率半径 R_{I_1} , R_2 が大きいときの組合せ接続では,斜め球面の曲率半径 R_{I_1} , R_2 が小さいときの組合せ接続に対して,許容回転角度 φ は小さくなる.例えば,斜め球面の傾斜角度 θ_1

が12度の場合,斜め球面の曲率半径 R₁, R₂が,各々12.5 mmと12.5 mm 及び5 mm と5 mm のときには,許容回転角度 φは,各々3.3 度 及び6.6 度になる.

4.4.2 斜め球面の接点の光軸からの偏心

図4.5~図4.7から、フェルール回転に起因する偏心 e_c は、フェルール回転角度 φ 、斜め球面の傾斜角度 θ_1 、及びテーパ・フェルールの斜め球面の曲率半径 R_1 、 R_2 の差異に依存することが判る。更に、曲率半径 R_1 、 R_2 が同一の値の組合せの接続では、偏心 e_c は、フェルールの回転角度 φ に、ほぼ直線的に比例して増加する。一方、曲率半径 R_1 、 R_2 に差異がある組合せの接続では、フェルール回転角度 φ が6~8度以下の範囲においては、yy座標上の偏心 e_{cy} の影響を受けて、フェルール回転角度 φ には直線的に比例しない。

4.4.3 斜め球面の接点の光軸に対する接触角度

フェルールの回転に起因して、斜め球面上の接点 Q_c は光軸 ZZ に対して接触角度 ψ_c が変化する.フェルール回転角度 φ が10度の範囲では、フェルールの回転角度 φ が各々0度及び10度のとき、接触角度 ψ_c の差異は、図 4.8 によれば、いずれも0.05 度以下である。同図から、フェルールの回転角度 φ が10 度程度の小さな領域では、フェルールの回転

4.4.4 フェルールの回転による挿入損失

APCコネクタにおいて、テーパ・フェルールの斜め球面に軸方向の 圧縮コイルばね力 W_oを負荷し、一対のテーパ・フェルールの斜め球面 を相互に接続した場合、前述のように、接触力 W_cが圧縮コイルばね力 W_oより大きい場合、光ファイバ端面間に生ずるエアギャップZ_cを消去 できない、第1章で記述したように、光ファイバ・コアと空気層との屈 折率差によりフレネル損失、光ファイバ端面間の多重反射、及びエァ ギャップZ_cによる光の減衰などが総合されて挿入損失が大きくなる、 次に、これらの要因による挿入損失の計算値を示す. 1) フレネル損失による挿入損失

光ファイバ1から空気層への出射光の透過率をT₁,空気層から光ファ イバ2への入射光の透過率をT₂とすれば、フレネル損失による挿入損 失IL_rは、第3章に記述した式(3.23)で与えられる[17].

式 (3.23) により計算した挿入損失 IL_{F} は各々0.38 dB及び0.34 dB になる.従って,光ファイバ端面間にエアギャップ Z_{c} が生じた場合,密 着状態に比較して上述の挿入損失 IL_{F} が加算される.

2) 多重反射による挿入損失

多重反射による挿入損失 IL_{R} は,第3章に記述した式 (3.24) により 与えられる[18]. この多重反射による挿入損失 IL_{R} は,光波長 λ の λ / 4に相当するエアギャップ毎に最大で約0.6 dBの挿入損失 IL_{R} を生ず る.

3) エァギャップによる光減衰

光ファイバ端面間の距離に応じて,光ファイバ量が減衰する.この光量の減衰による挿入損失 IL_A は,第3章に記述した式(3.25)により計算できる[19],[20].式(3.25)により計算した光量の減衰による挿入損失 IL_A は,光ファイバ端面の傾斜角度 θ_1 が12度及び8度について,各々0.14 dB / μ m, 0.09 dB / μ mになる.ただし,エァギャップ Z_c の範囲は100 μ m以内とする.

図 4.13 (a), (b)は、テーパ・フェルール付きAPCコネクタの斜め 球面の傾斜角度 $\theta_i = 12$ 度、及び $\theta_i = 8$ 度とし、一対のテーパ・フェルー ルの斜め球面の曲率半径 R_1 及び R_2 が、各々 12.5 mm と 12.5 mm, 12.5mm と 5mm、及び 5mm と 5mm の組合せについて、フェルール の回転角度 φ を 0 度から 10 度まで 1 度おきに変えた場合の挿入損失 *IL* を、式 (3.23)から式 (3.25)にもとずいて計算してプロットしたも のである、ただし、図 4.13 (a), (b)において、挿入損失 *IL*は、フレネ ル損失による挿入損失 *IL_F、多*重反射による挿入損失 *IL_R、及び光量の* 減衰による挿入損失 *IL_A*を合算した値を示す。

図4.13 (a), (b)において, 挿入損失の零dBは, 図4.10及び図4.12



図 4.13 傾斜角度 θ₁ が 12 度及び 8 度のテーパ・フェルールの回転 角度 φ と挿入損失 *IL*

の圧縮コイルばねによる接触力 W_0 を0.7 kgfのときのエァギャップ Z_c を零として,各々図4.9のエァギャップ Z_c の図から求めた.図4.13 (a), (b)では,挿入損失 *IL*は必ずしも所要接触力 W_c ,及びエァギャップ Z_c の変化とは比例しないことを示している.ここで,一対のテーパ・フェ

ルール端面の斜め球面の曲率半径 R_1 及び R_2 が異なる組合せの場合,特 に、斜め球面の端面傾斜角度 θ_1 が 12 度、及び曲率半径 R_1 , R_2 に差異 がある組合せの接続では、フェルール回転角度 φ が小さい領域において も、斜め球面の接点 Q の光軸 ZZ からの偏心の yy 座標成分 e_{cy} により 挿入損失 *IL* は大きい値を示す.

図4.13 (a), (b)によれば, 挿入損失*IL*のプロットは山と谷が不規則 に連続しているが, これは, 光ファイバ間の微小なエァギャップ*Z*_cが, 光波長λのλ/4になる毎に増減する光ファイバ端面間の多重反射によ る 0.6 dBに及ぶ光損失の影響が大きいためと考えられる.

更に,光コネクタの挿入損失の要因として,第1章で記述した光ファ イバ間の光軸ずれによる挿入損失 IL_aが加算される.

3.5 まとめ

第4章では、テーパ・フェルールが回転した状態で接続された場合の、 APCコネクタの形状特性、及び接続特性に関する普遍的な課題を明ら かにするために、フェルール回転角度 φ が0度から10度の範囲におい て、テーパ・フェルールの端面傾斜角度 θ_1 、斜め球面の曲率半径 R_1 と R_2 などをパラメータとして、次の項目について理論解析を行なった.

(a) 接続時の斜め球面の接点 Q_c の光軸 ZZ からの偏心 e_c

(b) 光ファイバ端面の接触角度 ψ_c

(c) 光ファイバ端面間に生ずるエァギャップZ_c

(d) エァギャップ Z_c を消去するための所要接触力 W_c

(e) フェルールの回転角度 φによる挿入損失 IL

解析結果は、次のように要約できる.

1) 接続時の斜め球面の接点 Q_c の光軸 ZZ からの偏心 e_c

曲率半径 R_1 , R_2 が同一の値の組合せの接続では, 偏心 e_c は, フェルー ルの回転角度 φ に, ほぼ直線的に比例して増加する. 一方, 曲率半径 R_1 , R_2 に差異がある組合せの接続では, フェルール回転角度 φ が6度以下の 範囲においては, yy 座標上の偏心 e_{cy} の影響を受けて, 偏心 e_c はフェ ルール回転角度 φ に直線的には増加しない. <第4章>

2) 光ファイバ端面の接触角度 ψ_c

フェルール回転角度φが10度以下の範囲では, 斜め球面の接点Q_cの 接触角度ψ_cは,フェルール回転角度φによる影響を殆ど受けない.

3) 光ファイバ端面間に生ずるエァギャップ Z_c

エァギャップ Z_c は、斜め球面の傾斜角度 θ_1 、曲率半径 R_1 と R_2 、及びフェルールの回転角度 φ の関数として与えられる.

4) エァギャップ Z_cを消去するための所要接触力 W_c

エァギャップ Z_c を消去するための所要接触力 W_c は, 斜め球面の傾斜 角度 θ_1 , 曲率半径 $R_1 \ge R_2$, 及びフェルールの回転角度 φ の関数として 与えられる.

5) フェルールの回転角度 φ による挿入損失 L

斜め球面の曲率半径 R_1 及び R_2 が異なる組合せの場合,特に,斜め球 面の端面傾斜角度 θ_1 が12度,及び曲率半径 R_1 , R_2 に差異がある組合 せの接続では、フェルール回転角度 ϕ が0度においても、斜め球面の接 点Qの光軸ZZからの偏心のyy座標成分 e_{cy} により挿入損失ILは大き い値を示す.挿入損失ILは光ファイバ端面間の多重反射による影響に より、その値は不規則に変化する.

以上の解析結果を更に要約すれば、テーパ・フェルール付きAPCコ ネクタの接続特性として、斜め球面の接点 Q_c の偏心 e_c 、エァギャップ Z_c 、および所要接触力 W_c は、フェルールの回転により拡大されると結 論できる.

第4章参考文献

- [1] M. Takahashi, "Experimental Considerations for APC Optical Connectors with Slanted Angle of 8 Degrees," School of Electronic Science and Technology of Shizuoka Univ. Vol.1-17. pp.89-95, 1996.
- [2] "技術指導資料: FC Type Fiber Optic Connector 図面," NTT アドバンステクノロジー株式会社, 1986.
- [3] "技術指導資料: SC Type Fiber Optic Connector 図面,"NTT アドバンステクノロジー株式会社, 1989.
- [4] M. Takahashi, "Compatibility of Conventional-Ferrule with Step-Ferrule for Angled Convex Optical Connectors," Proc, 45th IEEE ECTC, Lasvegas, pp. 406
 - 412, (May, 1995)
- [5] M. Takahashi, "Novel Stepped ferrule for angled convex polished optical fiber connector," Proc, IEEE OFC'95. San Diego, Vol. 8, pp. 184-185, (Feb, 1995)
- [6] M. Takahashi, "Compatibility for optical connectors with different slanted angles at their ferrule endfaces," Proc, IEEE CLEO / Pacific Rim'95, pp. 304. (July, 1995)
- [7] 高橋光雄, "斜め球面研磨光コネクタの接続端面角度差異による互換性"日本電子部品信頼性センタ、RCJ 第4回電子デバイスの信頼性シンポジューム、pp. 39 45, (11, 1995)
- [8] M. Takahashi, "Optical Connector Ferrule", US Patent. No. 5,140,660. 1992.
- [9] 杉田悦治,他, "斜めPC(APC)コネクタの互換性試験結果," 1995 信学春全大, C-289. 1995.
- [10] 平 淳司,他, "超低反射戻り光Angled-PCコネクタ," 1994信 学春全大, C-204. 1994.
- [11] 皆見浩二,他, "斜めPC (APC)コネクタの端面成形法," 1996信学春全大, B-991. 1996.
- [13] 皆見浩二,他, "斜めPC (APC)コネクタの端面成形法," 1996信
 学春全大, B-991. 1996
- [14] International Electrotechnical Commission, "INTERNATIONAL STANDARD

IEC 60874-14-6, Part 14-6: Detail specification for fibre optic connector Type SC-APC 9 ° untuned terminated to single-mode fibre type B1," pp. 6, 1997.

[15] 機械設計便覧編纂委員会, "機械設計便覧," 丸善株式会社.pp.1872, 1973.

第5章 ステップ・フェルール付きAPCコネクタの解析

フェルール回転角度 $\varphi \ge 0$ 度における接続特性

5.1 まえがき

APCコネクタの普遍的な形状特性及び接続特性については,第3章 及び第4章で解析を行った.その解析結果から,APCコネクタの接続 特性に影響する最大の要因として,フェルール端面に成形した斜め球面 の頂点の光軸からの偏心,及び接続時のフェルールの回転を挙げること ができる.そこで,第5章では,APCコネクタの接続特性の改善のた めに,フェルール端面の斜め球面の頂点の光軸からの偏心を極めて小さ くするために,新しいステップ・フェルール(Stepped-ferrule)を提 案し,その形状特性および接続特性について記述する.

新しいステップ・フェルールは形状に特徴があり, 先端部にフェルール外径より小径の段付き円筒部を設けたものである[1]. このような形状にすることによって, 斜め球面の頂点の光軸からの偏心を極めて小さくできる[2]-[5].

表4.1に示したように、従来のFC型コネクタ部品間の整列キーと整 列キー溝との間の隙間によるフェルールの回転角度 φは、相互のフェル ールについて最大で約16度に達する.一方、SC型コネクタ部品間で は最大で14.7度に達する[6],[7].このような、フェルールの回転角度 φを低減するためには、フェルール回転角度の範囲をできるだけ狭くな るように設計製作することが必要である.このために、APCコネクタ のフェルール回転による接続特性の改善を目的として、光コネクタ部品 間の整列キーと整列キー溝との間の隙間を小さくした、新しい光コネク タ部品の仕様を提案する.

第5章では、新しく提案したステップ・フェルール、及び新しく提案 したコネクタ部品により構成したAPCコネクタの形状特性、及び接続 特性について理論解析をする.理論解析では、ステップ・フェルールの 端面傾斜角度 θ_1 が各々8度と12度、斜め球面の曲率半径 R_1, R_2 が、各々 5.0 mmから12.5 mmの範囲、及びステップ・フェルールの回転角度



(a). Stepped-ferrule for use in FC and SC connectors.(Before an angled-convex is formed.).



(b). Stepped-ferrule for use in FC and SC connectors. (After an angled-convex is formed.).

図 5.1 FC型及びSC型APCコネクタステップ・フェルー ルの形状例

 φ が0~10度の場合について取り扱う.

5.2 ステップ・フェルールの形状

図5.1 (a), (b) に, FC型及びSC型コネクタ用として, 使用されて いるフェルールと互換性のあるステップ・フェルールについて, 斜め球 面成形研磨の前後での先端部の側面の形状を比較して示す. 図5.1 (a), (b) から, ステップ・フェルールの形状は, 先端部にフェルール外径よ り小径の段付き円筒部を設けたものである. なお, 整列キーの方向は, 図 5.1 (b)の斜線で示した位置に定めてある. なお, 本論文の図 5.1 に 提案した整列キーの位置の仕様は, 1997年に I E C 874-14-7 国際規



図 5.2 ステップ・フェルールの斜め球面成形研磨後の形状

格に採用された[8],[9].

5.3 ステップ・フェルールの形状の理論解析

5.3.1 斜め球面の頂点の光軸からの偏心

ステップ・フェルールの斜め球面成形研磨法としては,題2章で述べた,公転及び自転の複合運動をする弾性研磨盤に,固定保持したステッ プ・フェルール端面を押し付ける方式の球面研磨装置によるものが主流 である[10]-[12]. その球面はステップ・フェルール端面の円形外縁の 中心点を基準として,同心円状に成形研磨される性質をもっている [13].

図5.2は、ステップ・フェルールの斜め球面の頂点の光軸からの偏心 を求める解析図である.図5.2において、0,は斜め球面の光軸ZZに対 する直角面からの傾斜角度、R₁は斜め球面の曲率半径、O₁は曲率半径 R₁の中心、P_{S1}は斜め球面の頂点、S_sは、斜め球面球面の頂点P_{S1}の光 軸ZZからの偏心、m_sは研磨基準位置、及び2bは直円筒部の外径を各々 示す.前述のように、ステップ・フェルールは、その先端部に小径の直 円筒部を設けてある.従って、フェルール端面を斜め球面に研磨した場 合、研磨中心となるフェルール端面上の円形外縁のC(y)点とD(y)点



図 5.3 斜め球面の頂点 P_sの光軸 ZZ からの偏心 S_s

との中点E(y)点は, 光ファイバの光軸ZZに一致する. ただし, ステップ・フエルールの斜め研磨球面の頂点 P_{s1} は, 光ファイバ光軸zzから S_s だけ偏心する. この偏心 S_s は次の式(5.1)により計算できる.

$$S_s = R_1 (1 - \cos \alpha) \tan \theta_1 \tag{5.1}$$

ただし,

$$C(y) = D(y) \le b$$
, $0 \le \theta_1 \le \tan^{-1}(m_s / 2b)$,

$$\alpha = \sin^{-1}\left[\frac{C(y) - |D(y)|}{R_1 \cdot \cos\theta_1}\right],$$

ここで、 α は、線分 $O_1A(y)$ と $O_1E(y)$ の鋏角である.

式 (5.1) により計算したステップ・フェルールの斜め球面の頂点位 置 P_{s1} の,光ファイバ光軸 zz からの偏心 S_s を図 5.3 に示す.第3章で 記述したテーパ・フェルールの偏心 S_c は,斜め球面の傾斜角度 θ_1 が, 各々 12 度及び 8 度の場合,150 ~ 166 µm 及び 102 ~ 114 µm であっ たが,ステップ・フェルールの場合は、この偏心 S_s は、斜め球面の傾 斜角度 θ_1 が 12 度及び 8 度の場合,4.3 ~ 10.9 µm 及び 2.8 ~ 7.1 µm



(a). Shift e_{sy} of contacting point Q_s on ordinate yy.



(b). Shift e_{sr} of contacting point Q_s on abscissa xx.

図 5.4 ステップ・フェルール 2 の回転に起因する斜め端面の接 点 Q_s の光軸 ZZ からの偏心 e_{sv} 及び e_{sx}

と極めて小さな値にできる.

5.3.2 斜め球面の接点の光軸からの偏心

図 5.4 (a),(b) は,各ステップ・フェルールの斜め球面の傾斜角度 θ_1 を各々同一とし,曲率半径 R_1 , R_2 を各々同一として,各々уу軸及びxx 軸について,斜め球面の接点 Q_s の光軸ZZからの偏心 e_s を求めるため の解析図である.図 5.4 (a),(b)において,APCコネクタのフェルー ル2を,回転角度 φ <90度の範囲で回転させたと仮定している.図 5.4 (a)は,斜め球面の接点 Q_c の光軸ZZからの偏心 e_{sy} のyy軸座標を求め る解析図である.図 5.4 (b)は,斜め球面の接点 Q_s の光軸ZZからの偏 心 e_{sx} のxx軸座標を求める解析図である.ここで, ψ_{sy} , ψ_{sx} は,各々 yy 座標及びxx 座標における斜め球面の接点Q_sの光軸ZZ に対する接触角度を示す.各々の理論式は,図5.4の解析図から次のように求めることができる.

1) 斜め球面接点 Q_sの光軸 ZZ に対する偏心の yy 座標 e_{sy}

図 5.4 (a)において,ステップ・フェルール1を固定して,ステップ・フェルール2を,回転角度 φ <90度の範囲で回転させたと仮定する.この場合,前述のように,ステップ・フェルール2の曲率半径 R_2 の中心点 O_2 は,図 5.4に示す点 O_p を回転中心,光軸ZZを回転軸として, H_{s2} を回転半径とする円軌跡に沿って回転する.ここで,点 O_p は斜め球面の頂点 P_{s2} と曲率半径 R_2 の中心点 O_2 とを結ぶ線分 $P_{s2}O_2$ と光軸ZZ との交点である.従って,回転角度 φ において,ステップ・フェルール2の斜め球面の頂点 P_{s2} の光軸ZZ からの偏心を S_{s2} 'とすれば, S_{s2} 'は式(5.2)より求められる.

$$S_{s2}' = S_{s2} \cdot \cos\varphi \tag{5.2}$$

回転角度 φ における曲率半径 R_2 の中心点 O_2 の光軸ZZからの距離を H_{s2} 'とすれば、 H_{s2} 'は式(5.3)により求められる.

$$H_{s2}' = H_{s2} \cdot \cos\varphi \tag{5.3}$$

回転角度 φ におけるステップ・フェルール2の斜め球面の傾斜角度を θ_1 'とすれば、 θ_1 'は式(5.4)より求められる.

$$\theta_1' = \theta_1 \cdot \cos \varphi$$

(5.4)

ステップ・フェルール2の斜め球面上の接点 Q_s のyy座標における 光軸ZZからの偏心 e_{sy} は,各々の曲率半径 R_1 , R_2 の中心点 O_1 , O_2 の 光軸ZZからの距離 H_{s1} , H_{s2} 'の合計値($H_{s1} + H_{s2}$ ')を,各ステップ・ フェルールの斜め球面の曲率半径 R_1 , R_2 の比率で分割した位置にある. 従って,ステップ・フェルール2の斜め球面の接点 Q_s のyy座標におけ る偏心 e_{sy} は,次の式(5.5)より求めることができる.

$$P_{Sy} = \frac{1}{\cos\psi_{Sy}} \left[\frac{R_1 \left(|H_{S1}| + H_{S2}' \right)}{R_1 + R_2} - |H_{S1}| \right]$$
(5.5)

ここで、ステップ・フェルール1の曲率半径 R_1 の中心点 O_1 の光軸ZZからの距離 H_{s_1} は、式(5.6)により求められる.

$$H_{s1} = R_1 \sin\theta_1 - S_{s1} \cos\theta_1 \tag{5.6}$$

同様にして、ステップ・フェルール2の曲率半径 R_2 の中心点 O_2 の光軸 ZZ からの距離 H_{s2} 'は、式(5.7)により求められる.

 $H_{s2}' = \left(R_2 \sin \theta_1 - S_{s2} \cos \theta_1\right) \cos \varphi \tag{5.7}$

従って,式(5.5)に式(5.6)及び式(5.7)を代入すれば,式(5.5)は, 次の式(5.8)のようになる.

$$e_{Sy} = \frac{R_{1} \left[\left| R_{1} \sin \theta_{1} - S_{S1} \cos \theta_{1} \right| + \left(R_{2} \sin \theta_{1} - S_{S2} \cos \theta_{1} \right) \cos \varphi \right]}{(R_{1} + R_{2}) \cos \psi_{Sy}} \\ - \frac{\left| R_{1} \sin \theta_{1} - S_{S1} \cos \theta_{1} \right|}{\cos \psi_{Sy}} \\ = \frac{R_{1} \left(R_{2} \sin \theta_{1} - S_{S2} \cos \theta_{1} \right) \cos \varphi - R_{2} \left| R_{1} \sin \theta_{1} - S_{S1} \cos \theta_{1} \right|}{(R_{1} + R_{2}) \cos \psi_{Sy}}$$
(5.8)

2) 斜め球面接点 Q_s の光軸 ZZ に対する zz-yy 平面上での傾斜角度 ψ_{sy}

式 (5.5), (5.8) において, ψ_{sy} は, 斜め球面の接点 Q_s の光軸 ZZ に 対するzz-yy平面上での傾斜角度であり, 図5.4から式 (5.9)より求め ることができる.

$$\psi_{sy} = \sin^{-1} \left(\frac{|H_{s1}| + H_{s2}'}{R_1 + R_2} \right)$$

= $\sin^{-1} \left[\frac{|R_1 \sin \theta_1 - S_{s1} \cos \theta_1| + (R_2 \sin \theta_1 - S_{s2} \cos \theta_1) \cos \varphi}{R_1 + R_2} \right]$ (5.9)

3) 斜め球面の接点Q_sの光軸ZZ に対する偏心のxx 座標 e_{sx}
 図 5.4 (b) において、ステップ・フェルール2が角度φ だけ回転し

た場合,斜め球面の接点 Q_s のxx座標を X_c として表わす. X_c は式(5.10) より求めることができる.

 $X_{s} = H_{s2} \cdot \sin \varphi$

斜め球面の接点Q_sの光軸ZZに対する偏心のxx座標*e_{sx}*は,式(5.11) より求めることができる.

$$e_{SX} = \frac{R_1 \cdot H_{S2} \cdot \sin\varphi}{(R_1 + R_1)\cos\psi_{SX}}$$
(5.11)

4) 斜め球面の接点 Q_sの光軸 ZZ に対する zz-yy 平面上での傾斜角度 ψ_{sx} 斜め球面接点 Q_sの光軸 ZZ に対する zz-yy 平面上での傾斜角度 ψ_{sx} は,式(5.12)で求めることができる.

$$\psi_{sx} = \tan^{-1} \left[\frac{H_{s2} \cdot \sin\varphi}{(R_1 + R_1) \cos\psi_{sy}} \right]$$
(5.12)

5) 斜め球面接点 Q_sの光軸 ZZ に対する偏心 e_s

(5.10)

図 5.5 (a), (b) は,ステップ・フェルール1とステップ・フェルール 2の斜め球面の曲率半径 R_1 , R_2 が同一である場合,及び異なる場合につ いて,偏心 e_s 及び斜め球面の接点 Q_s の軌跡を求める解析図である.こ こで,図 5.5 (a), (b) は,図 5.4の解析図を光軸ZZ方向から視た図で ある.フェルール2の回転角度が φ において,偏心 e_s は,各々уу座標 およびxx座標の斜め球面接点 Q_s の光軸ZZに対する偏心 e_{sy} ,及び e_{sx} を総合したものである.斜め球面の接点 Q_s は,回転角度 φ の変化に伴っ て移動する.

図 5.5 (a) は、フェルール1と2の斜め球面の曲率半径 R_1 、 R_2 が同 ーの場合について示したものである. 斜め球面接点 Q_s の光軸ZZに対す る偏心 e_s は、ステップ・フェルール1の斜め球面の曲率半径 R_1 の中心 O_1 と、ステップ・フェルール2の斜め球面の曲率半径 R_2 の中心 O_2 とを 結ぶ線分L上にある. 更に、yy座標およびxx座標での、斜め球面接点 Q_s の光軸ZZに対する偏心 e_{sy} 及び e_{sx} のベクトル和を表わす点 Q_s は、



(a). $R_1 = R_2$.

(b). $R_1 > R_2$.

図 5.5 斜め球面の接点 Q_sの光軸 ZZ に対する偏心 e_sと移動軌跡

 $O_1 と O_2 を結ぶ線分L上にある. 従って、斜め球面接点<math>Q_c$ の光軸ZZに 対する偏心 e_s は式(5.13)により求めることができる.

 $e_{\rm s} = \sqrt{e_{\rm SX}^2 + e_{\rm Sy}^2} \tag{5.13}$

6) 角度 φによる斜め球面の接点 Q_sの移動を表わす軌跡

角度 φ の増加に伴う斜め球面の接点 Q_s の移動を表わす軌跡 L_I のxy 平面上に座標は、式(5.5)及び(5.11)から計算できる. 図5.5では、 移動軌跡 L_I の形状は円になる. この移動軌跡円 L_I の半径 L_R は式(5.14) により求めることができる.
$$L_{R} = \frac{1}{2} \left\{ \left| H_{S1} \right| - \left[\frac{\left| H_{S1} \right| \left(\left| H_{S1} \right| - H_{S2} \right)}{\left| H_{S1} \right| - H_{S2}} + e_{Sy'} \right] \right\}$$

$$= \frac{2 \left| H_{S1} \right| \cdot H_{S2} - \left(\left| H_{S1} \right| + H_{S2} \right) e_{Sy'}}{2 \left(\left| H_{S1} \right| + H_{S2} \right)}$$
(5.14)

ただし、 e_{sy} 'は回転角度 $\varphi = 0$ 度における yy 座標における偏心である.

曲率半径 R_1 , R_2 が同一の場合, $H_{s1} = H_{s2}$ となり, 角度 φ の増加による接点 Q_s の移動軌跡 L_1 は, 半径 L_R が ($H_{s1}/2$)の正円になる. これは, 図 5.5 及び式 (5.14) から理解できる. 一方, 曲率半径が $R_1 > R_2$ の場合には, 図 5.5 (b) に示すように, 回転角度 φ =0度においても偏心 e_{sy} 、が生じている. ただし, 図 5.3 に示したように, ステップ・フェルールの場合には, この e_{sy} 、は非常に小さく無視できる大きさである.

7) 回転角度 φ に対応する斜め球面接点 Q_s の光軸 ZZ に対する傾斜角度 ψ_s

図 5.5 から,斜め球面接点 Q_s の光軸 ZZ に対する傾斜角度 ψ_s は,式 (5.15) により求めることができる.

$$\psi_{s} = \sin^{-1} \left[\frac{\sqrt{\left(\left| H_{s_{1}} \right| + H_{s_{2}} \cdot \cos \varphi \right)^{2} + \left(H_{s_{2}} \cdot \sin \varphi \right)^{2}}}{R_{1} + R_{2}} \right]$$
(5.15)

従って、回転角度 $\varphi = 0$ 度の場合は、式(5.16) により傾斜角度 ψ_s を求めることができる.

$$\psi_{s} = \sin^{-1} \left[\frac{\sqrt{\left(|H_{s1}| + H_{s2} \cdot \cos\varphi \right)^{2}}}{R_{1} + R_{2}} \right]$$
(5.16)

回転角度 φ = 90 度の場合は、式 (5.17) により傾斜角度 ψ_s を求めることができる.



図 5.6 ステップ・フェルールの回転による斜め球面の接点 Q_sの光軸に対する偏心 e_s

$$\psi_{s} = \sin^{-1} \left[\frac{\sqrt{|H_{s1}|^{2} + (H_{s2} \cdot \sin \varphi)^{2}}}{R_{1} + R_{2}} \right]$$
(5.17)

図5.6から図5.8に、斜め球面の傾斜角度の1が12度及び8度のステッ



図 5.7 ステップ・フェルールの回転による斜め球面の接点 Q_sの光軸に対する偏心 e_s

プ・フェルールについて、フェルールの回転による斜め球面の接点 Q_s の光軸に対する偏心 e_s を示す.各々の図の偏心 e_s は以上の理論解析による計算式により求めたものである、

ー対のステップ・フェルールの斜め球面の曲率半径 R₁, R₂の組合せ

<第5章>



図 5.8 ステップ・フェルールの回転による斜め球面の接点 Q_sの光軸に対する偏心 e_s

が,各々12.5 mmと12.5 mm, 12.5 mmと10 mm, 12.5 mmと 7.5 mm,及び12.5 mmと5 mmの場合について,ステップ・フェ ルール2の回転角度 φを0度から10度まで2度おきに変えたときのフェ ルールの回転に伴う斜め球面の接点Q_sの光軸に対する偏心e_sを図5.6 に示す.

ー対のステップ・フェルールの斜め球面の曲率半径 $R_{I_{1}}$ R_{2} の組合せ が,各々10 mmと10 mm,10 mmと7.5 mm,及び10 mmと5 mmの場合について,ステップ・フェルール2の回転角度 φ を0度から 10 度まで2 度おきに変えたときの値を計算した,フェルールの回転に 伴う斜め球面の接点 Q_sの光軸に対する偏心 e_sを図 5.7 に示す.

ー対のステップ・フェルールの斜め球面の曲率半径 $R_{1,}$ R_{2} の組合せ が,各々7.5 mmと7.5 mm,及び7.5 mmと5 mm,並びに,5 mm と5 mmの場合について、ステップ・フェルール2の回転角度 φ を0度 から10度まで2度おきに変えたときの値を計算した、フェルールの回 転に伴う斜め球面の接点Q_sの光軸に対する偏心 e_{s} の値を図5.8に示す.

図 5.6 ~ 図 5.8 から,フェルール回転に起因する,斜め球面接点 Q_s の光軸 ZZ に対する偏心 e_sは,フェルール回転角度 φ,斜め球面の傾斜 角度 θ₁,及びステップ・フェルールの斜め球面の曲率半径 R₁, R₂の差 異に依存することが判る.

ただし、ステップ・フェルールの場合には、曲率半径 R_1 、 R_2 が同一、 またはことなる値の組合せの接続においても、偏心 e_s はテーパ・フェ ルールのように yy 座標上の偏心 e_s の影響を受けない特徴をもってい る.この点は、テーパ・フェルールの場合と異なるステップ・フェルー ルの大きな利点である.

5.3.3 斜め球面の接点の光軸に対する接触角度

フェルール回転に起因する, 斜め球面上の接点 Q_s の光軸ZZに対する 接触角度 ψ_s を,式(5.15)により計算して図5.9に示す.ここでは,斜 め球面の傾斜角度 θ_1 が8度及び12度,一対のステップ・フェルールの 斜め球面の曲率半径 R_{I_1} , R_2 の組合せが,各々12.5 mmと12.5 mm, 12.5 mmと5 mm,及び5 mmと5mmの場合について,ステップ・ フェルール2の回転角度 φ を0度から10度まで2度おきに変えたとき の値を計算した.

この斜め球面の接点 Q_s の光軸ZZに対する接触角度 ψ_s は、一般に、斜



図 5.9 ステップ・フェルール回転角度による斜め球面の接点 Q_sの光軸 ZZ に対する接触角度 ψ_s

め球面の傾斜角度 θ_1 ,及びステップ・フェルールの斜め球面の曲率半径 R_1 , R_2 の差異に依存する.しかし、ステップ・フェルールの回転角度 φ が10度以下の範囲では、フェルールの回転による影響は殆ど受けてい ない.更に、曲率半径 R_1 , R_2 の差異が大きいステップ・フェルールの 組合せの接続では、曲率半径 R_1 , R_2 が同一の場合に比較して、接触角





度 ψ_c は若干小さな値になることが図 5.9 から判る.

第4章で記述したように、テーパ・フェルールの場合は、斜め球面の 傾斜角度 θ_1 が12度、斜め球面の曲率半径 R_1 、 R_2 の組合せが、各々12.5 mm と12.5 mm、12.5 mm と5 mm、及び5 mm と5 mmの場合、 接触角度 ψ_c は、各々11.3度、10.95度及び10.10度に低下した. 一 方、ステップ・フェルールの場合、接触角度 ψ_s は11.85度以上に保た れている. このような接触角度の特性はステップ・フェルールの利点で ある.

5.3.4 光ファイバ端面間のエァギャップ

フェルール回転によるエァギャップ*Z*_sは,式(3.18)によって得られた次の式(5.18)で求めることができる.

$$Z_{s} \simeq (R_{1} + R_{2})e_{s}^{2}/2R_{1} \cdot R_{2}$$
(5.18)

図 5.10 は、式 (5.18) により計算した、 接触圧力が零の時の光ファ イバ光軸ZZ上のエァギャップZ。である.ただし,斜め球面の傾斜角度 θ,が12度及び8度,及び一対のステップ・フェルールの斜め球面の曲 率半径 R, R,の組合せが,各々12.5 mmと12.5 mm, 12.5 mmと 5 mm, 及び5 mm と5 mm の場合について, ステップ・フェルール 2の回転角度 φを0度から10度まで2度おきに変えたときの値を計算 した.フェルールの回転による接触圧力が零の時,光ファイバ光軸ZZ 上のエァギャップZ。は、フェルールの回転角度φ、斜め球面の傾斜角度 θ,,及びステップ・フェルールの斜め球面の曲率半径 R₁, R₂の差異に 依存する.ここで,ステップ・フェルールの場合は,曲率半径 R₁, R₂ が同一,または差異のある接続の場合でも,ステップ・フェルールの回 転角度 φが0 度の時には、このエァギャップ Z_sは零または近似的に零 になる特徴がある.これは, yy座標上の偏心esvが極めて小さいためで ある.この点はステップ・フェルールの接続特性の特徴である.テーパ・ フェルールの場合には、図4.9について記述したように、曲率半径 R₁, R_2 に差異のある接続の場合は、yy座標上の偏心 e_{cy} の影響により、テ -パ・フェルールの回転角度 φ が0度の時には、このエァギャップ Z_c は零にはならなかった.

5.4 フェルール回転による接続特性の理論解析

第5.4項では,前述の形状特性をもっているステップ・フェルールを



図 5.11 ステップ・フェルールの回転角度による光ファイバ 光軸 ZZ 上のエァギャップ Z_sを消去するための所要 接触力 W_s

使用して構成したAPCコネクタの接続特性において,光ファイバ端面間のエァギャップZ_sを消去するために要する軸方向の接触力W_sについて記述する.

曲率半径 R_1 及び R_2 の 2 個の中実球面を接触させて,接触力 W_s で接



光軸 ZZ 上のエァギャップ Z_sを消去するための所要接 触力 W_s

触点を押した場合,球面の弾性変形により生ずる円形平面の半径rは, 式(3.19)に引用した Hertz の弾性方程式により与えられる [14].

ここで、各々テーパ・フェルールの材質をジルコニア・セラミックと して、ヤング率 $E_1 = E_2 = 15,000 \text{ kgf/mm}^2$ 、ポアソン比 $v_1 = v_2 = 0.3$



図 5.13 ステップ・フェルールの回転角度による光ファイバ 光軸 ZZ 上のエァギャップ Z_sを消去するための所要接 触力 W_s

とすれば、フェルール回転により生じた、光ファイバ光軸 ZZ 上のエァ ギャップ Z_s を消去するのに必要な、軸方向の所要接触力 W_s は、式 (5.19) で求めることができる [14].

$$W_{s} = \left(\frac{e_{s} + a}{0.045}\right)^{3} \cdot \frac{R_{1} + R_{2}}{R_{1} \cdot R_{2}}$$
(5.19)

斜め球面の傾斜角度 θ_i が,各々12度及び8度のステップ・フェルールについて,式(5.19)により計算した光ファイバ光軸上のエァギャップ Z_s を消去するのに必要な,軸方向の所要接触力 W_s を図5.11から図5.13に示す.

ー対のステップ・フェルールの斜め球面の曲率半径 $R_{1,}$ R_{2} の組合せ が,各々12.5 mmと12.5 mm, 12.5 mmと10 mm, 12.5 mmと 7.5 mm,及び12.5 mmと5 mmの場合について,ステップ・フェ ルール2の回転角度 φ を0度から10度まで2度おきに変化させたとき の値を図 5.11 に示す.グレイの塗色部分は,光コネクタ・プラグに内 蔵されたコイルばね力 W_{0} を0.7 kgf と仮定したときに,光ファイバ端 面が密着できる領域を示す.

一対のステップ・フェルールの斜め球面の曲率半径 $R_{1,}$ R_{2} の組合せ が,各々10 mmと10 mm,10 mmと7.5 mm,及び10 mmと5 mmの場合について、ステップ・フェルール2の回転角度 φ を0度から 10 度まで2 度おきに変えたときの値を図 5.12 に示す.

ー対のステップ・フェルールの斜め球面の曲率半径 R_{I_1} , R_2 の組合せ が,各々7.5 mmと7.5 mm,及び7.5 mmと5 mm,並びに,5 mm と5 mmの場合について,ステップ・フェルール2の回転角度 φ を0度 から10 度まで2 度おきに変えたときの値を図 5.13 に示す,

図 5.11 ~ 図 5.13 によれば、軸方向の所要接触力 W_s は、ステップ・フェルール1 に対するステップ・フェルール2 の回転角度 φ の増加に伴って急激に増大する。更に、軸方向の所要接触力 W_s は、斜め球面の曲率半径 R_1 , R_2 の差異が大きいほど、また、曲率半径が大きいほど増加する。ただし、ステップ・フェルールの所要接触力 W_s は、曲率半径 R_1 , R_2 が同一、及び差異のある接続の場合でも、ステップ・フェルールの回転角度 φ が0 度の時には、この所要接触力 W_s は零、または近似的に零になる。これは、yy 座標上の偏心 e_{sy} が極めて小さいためである。

この点は、ステップ・フェル-ルの接続特性の特徴である.

テーパ・フェルールの場合は、図 4.10 ~図 4.12 において記述した ように、曲率半径 R_1 , R_2 に差異のある接続の場合には、テーパ・フェ ルールの回転角度 φ が0度の時でも、yy 座標上の偏心 e_{cy} の影響によ り、この所要接触力 W_s は零にはならなかった.

5.5 考察

5.5.1 ステップ・フェルールの接続時の許容回転角度

以上に、ステップ・フェルールを使用して構成したAPCコネクタに ついて、ステップ・フェルールが回転した場合の、ステップ・フェルー ルの接続端面の形状特性、及び接続特性について解析結果を記述した. これらの解析結果から、特に、光ファイバ端面間のエァギャップ*Z*sを 消去するための所要接触力*W*sは、接続時のステップ・フェルールの回 転角度 φにより大きな影響を受けることが判ったので、ステップ・フェ ルールの接続時の許容回転角度について考察する.

斜め球面の傾斜角度 θ_1 が,各々12度及び8度であって,ステップ・フェルール1及びステップ・フェルール2の斜め球面の曲率半径 R_1 , R_2 が変化した場合について,光ファイバ端面間のエァギャップ Z_s を消去できるステップ・フェルールの許容回転角度 φ を表5.1に示す.表5.1の許容回転角度 φ は,図5.11~5.13から求めたものである.ここでは,光コネクタのコイルばねの有効接触力を $W_0 = 0.7$ kgf と仮定した.

ここで、ステップ・フェルールの接続において、斜め球面の傾斜角度 θ_1 が12度の場合に、斜め球面の曲率半径 $R_{1,} R_2$ の組合せの範囲が、各々 12.5 mm と 5 mm のとき、光ファイバ端面間のエァギャップ Z_s を消 去すると仮定する.表5.1によれば、ステップ・フェルールの回転角度 を4.6度に制限しなければならない。一方、斜め球面の傾斜角度 θ_1 が8 度の場合に、斜め球面の曲率半径 $R_{1,} R_2$ の組合せの範囲が、各々12.5 mm と 5 mm のとき、光ファイバ端面間のエァギャップ Z_s を消去する ためには、ステップ・フェルールの回転角度 φ を6.9度に制限しなけれ

148

Convex radius R_1 and R_2 (mm)	Slanted angle $\theta_1 = 12$ degrees	Slanted angle $\theta_I = 8$ degrees
12.5 and 12.5 12.5 and 10.0 12.5 and 7.5 12.5 and 5.0 10.0 and 10.0 10.0 and 7.5 10.0 and 5.0	$< 3.2^{\circ} < 3.5^{\circ} < 3.9^{\circ} < 4.6^{\circ} < 3.7^{\circ} < 4.4^{\circ} < 4.9^{\circ}$	$< 4.6^{\circ} < 5.0^{\circ} < 5.5^{\circ} < 6.9^{\circ} < 5.4^{\circ} < 6.0^{\circ} < 7.0^{\circ}$
7.5 and 7.5 7.5 and 5.0 5.0 and 5.0	$< 3.6^{\circ} < 5.0^{\circ} < 5.7^{\circ}$	${<}6.4^{\circ} \ {<}7.4^{\circ} \ {<}8.9^{\circ}$

表 5.1 光ファイバ 端面を密着できるステップ・フェル - ルの許容回転角度 φ

ばならないことを示している.

5.5.2 APCコネクタ用の構成部品仕様の提案

表5.1 に要約したように、ステップ・フェルールにおいて、斜め球面の傾斜角度 θ₁が12度の場合には、斜め球面の曲率半径 R₁, R₂の組合せの範囲が、各々12.5 mm と5 mm のとき、光ファイバ端面間のエァ ギャップ Z_sを消去するためには、ステップ・フェルールの回転角度 φを 4.6 度に制限しなければならない。従って、前述の図 4.1 及び表 4.1 に 示したような、従来の P C コネクタを対象として設計されたコネクタ部 品の仕様を、そのまま、A P C コネクタに転用することはできないこと が判る.ただし、接続時の実際のフェルール回転角度は、計算値よりも 小さいものと経験的に推定される。従って、ここでは、フェルール回転 の許容回転角度を4度を満足し、更に製造コストの上昇を招かないよう

表 5.2 新たに提案する F C 型,及び S C 型コネクタの整列 キーと整列キー溝とによる隙間の寸法諸元の一例.

		- · · ·	
Locations of key		Dimensions	Rotation angle
and key-slit		(mm)	(degrees)
Ferrule key-slit	: W1	1.48 -1.50	
Holder key	: W2	1.45 -1.47	Up to 1.3
Adaptor key-slit	: W3	2.03 -2.07	
Plug key	: W4	1.98 -2.02	Up to 1.7
Total rotation angl	e : φ		Up to 4.0

(a). FC connector components.

(b). SC connector components.

Locations o	f key	Dimensions	Rotation angle
and key-slit		(mm)	(degrees)
Ferrule key-slit	: W1	1.48 -1.50	
Holder key	: W2	1.45 -1.20	Up to 1.3
Outer plug	: W3	5.62 -5.65	
Inner plug	: W4	5.58 -5.60	Up to 2.1
Adaptor	: W5	9.02- 9.07	
Outer plug	: W6	8.88 -8.90	Up to 1.3
Total rotation angle : φ			Up to 4.7

に考慮した.

そこで,表5.2に,APCコネクタ用コネクタ部品の新しい設計仕様 を提案する.

5.5.3 斜め球面の接点の光軸からの偏心

図5.6~図5.8から、フェルール回転に起因する偏心 e_s は、フェルール回転角度 φ 、斜め球面の傾斜角度 θ_1 、及びステップ・フェルールの斜め球面の曲率半径 R_1 、 R_2 の差異に依存することが判る.ただし、ステップ・フェルールの場合は、曲率半径 R_1 、 R_2 が同一、または異なる値の組合せの接続においても、偏心 e_s はフェルールの回転角度 φ にほぼ直線的に比例して増加する.

5.5.4 斜め球面の接点の光軸に対する接触角度

フェルールの回転に起因して, 斜め球面上の接点 Q_s は光軸ZZに対し て接触角度 ψ_s が変化する.フェルール回転角度 φ が10度の範囲では, フェルールの回転角度 φ が各々0度及び10度のとき,接触角度 ψ_s の差 異は,図5.9によれば、いずれも0.05度以下である.同図から、フェ ルールの回転角度 φ が10度程度の小さな領域では、フェルールの回転 による接触角度 ψ_s の変化は無視できる.

5.5.5 フェルールの回転による挿入損失

APCコネクタにおいて、ステップ・フェルールの斜め球面に軸方向の圧縮コイルばね力W_oを負荷し、一対のステップ・フェルールの斜め球面を相互に接続した場合、前述のように、接触力W_sが圧縮コイルばね力W_oより大きい場合、光ファイバ端面間に生ずるエアギャップZ_cを消去できない.この場合、第1章で記述したように、光ファイバ・コアと空気層との屈折率差によりフレネル損失、光ファイバ端面間の多重反射、及びエァギャップZ_cによる光の減衰などが総合されて挿入損失が大きくなる.次に、これらの要因による挿入損失の計算値を示す.

1) フレネル損失による挿入損失

光ファイバ1から空気層への出射光の透過率を T_{I} ,空気層から光ファ イバ2への入射光の透過率を T_{2} とすれば、フレネル損失による挿入損 失 IL_{F} は、第3章に記述した式(3.23)で与えられる[16].

式 (3.23) により計算した挿入損失 IL_F は各々0.38 dB及び0.34 dB になる.従って,光ファイバ端面間にエアギャップ Z_c が生じた場合,密 着状態に比較して上述の挿入損失 IL_F が加算される.

2) 多重反射による挿入損失

多重反射による挿入損失 IL_{R} は、第3章に記述した式(3.24)により 与えられる[17]. この多重反射による挿入損失 IL_{R} は、光波長 λ の λ / 4に相当するエァギャップ毎に最大で約0.6 dBの挿入損失 IL_{R} を生ず る.

3) エァギャップによる光減衰

151



図 5.14 傾斜角度 θ₁ が 12 度及び 8 度のステップ・フェルールの回転 角度 φと挿入損失 IL

光ファイバ端面間の距離に応じて、光ファイバ量が減衰する.この光量の減衰による挿入損失 IL_A は、第3章での記述した式(3.25)により計算できる[18]、[19].式(3.25)により計算した光量の減衰による挿入損失 IL_A は、光ファイバ端面の傾斜角度 θ_1 が12度及び8度について、

各々0.14 dB / μm, 0.09 dB / μm になる. ただし, エァギャップ *Z*_sの範囲は100 μm 以内とする.

図 5.14 (a), (b)は、ステップ・フェルール付きAPCコネクタの斜 め球面の傾斜角度 $\theta_1 = 12$ 度、及び $\theta_1 = 8$ 度とし、一対のテーパ・フェ ルールの斜め球面の曲率半径 R_1 及び R_2 が、各々12.5 mmと12.5 mm、 12.5mmと5mm、及び5mmと5mmの組合せについて、フェルール の回転角度 φ を0度から10度まで1度おきに変えた場合の挿入損失*IL* を、第3章に記述した式(3.23)から式(3.25)にもとずいて計算し てプロットしたものである.ただし、図 5.14 (a), (b)において、挿入 損失*IL*は、フレネル損失による挿入損失*IL_F、多*重反射による挿入損失 *IL_R、及び光量の減衰による挿入損失IL_Aを合算した値を示す*.

図 5.14 (a), (b)において,挿入損失の零dBは,図 5.11及び図 5.13 の圧縮コイルばねによる接触力 W_0 を0.7 kgfのときのエァギャップ Z_c を零として,各々図 5.10のエァギャップ Z_c の図から求めた.図 5.14 (a), (b)では,挿入損失*IL*は必ずしも所要接触力 W_c ,及びエァギャップ Z_c の変化とは比例しないことを示している.

図 5.14 (a), (b)によれば, 挿入損失 *IL*のプロットは山と谷が不規則 に連続しているが, これは, 光ファイバ間の微小なエァギャップ*Z*_cが, 光波長λのλ/4になる毎に増減する光ファイバ端面間の多重反射によ る 0.6 dB に及ぶ光損失の影響が大きいためと考えられる.

更に,光コネクタの挿入損失の要因として,第1章で記述した光ファ イバ間の光軸ずれによる挿入損失 *IL*_dが加算される.

5.6 まとめ

第5章では,第3章,及び第4章で問題提起した,テ-パ・フェルー ル付きAPCコネクタの課題を解決している.すなわち,第5章ではス テップ・フェルール付きAPCコネクタを新たに提案し,この新しいA PCコネクタについて,フェルール回転角度φ≧0°の条件における形 状特性,及び接続特性の理論解析を行って,その優位性を明らかにし た.更に,接続特性を改善するために,APCコネクタの構成部品の設 計仕様の改善を提案した.これらは,次のように要約できる.

1) 斜め球面の頂点 P_{s1} の光軸 ZZ からの偏心 S_c

斜め球面の頂点P_{s1}の光軸ZZからの偏心 S_sは, テーパ・フェルール に比較して1/15から1/35と無視できる程度に低減できる.

2) 接続時の斜め球面の接点 Q。の光軸 ZZ からの偏心 e。

斜め球面の接点Q_sの光軸ZZからの偏心*e_s*は,曲率半径*R₁, R₂*の差 異には無関係であり,偏心*e_s*はフェルールの回転角度*φ*にほぼ直線的に 比例する.

3) 光ファイバ端面の接触角度 ψ_s

斜め球面の接点 Q_s の接触角度 ψ_s は、フェルールの回転角度 φ による影響を殆ど受けず微小である.

4) 光ファイバ端面間に生ずるエァギャップ Z_s

光ファイバ端面間に生ずるエァギャップZ_sは、回転角度φの一次関数 として近似される.

5) エァギャップ Z_s を消去するための所要接触力 W_{s} .

所要接触力 W_s は、斜め球面の傾斜角度 θ_i 、斜め球面の曲率半径 R_i と R_2 、及びフェルールの回転角度 φ の関数として与えられる.

6) フェルールの回転角度 φ による挿入損失 L

フェルール回転角度 φによる挿入損失 IL の値は,フェルール回転角 度 φを超える領域では増加する.

以上,得られた結論は、フェルールが回転して接続された場合の、ス テップ・フェルールを使用したAPCコネクタの基本接続特性として普 遍的なものである.

154

第5章参考文献

- [1] M. Takahashi, "Optical Connector Ferrule", US Patent. No. 5,140,660. 1992.
- [2] M. Takahashi, "Compatibility of Conventional-Ferrule with Step-Ferrule for Angled Convex Optical Connectors," Proc, 45th IEEE ECTC, Lasvegas, pp. 406-412, (May, 1995)
- [3] M. Takahashi, "Novel Stepped ferrule for angled convex polished optical fiber connector," Proc, IEEE OFC' 95. San Diego, Vol. 8, pp. 184-185, (Feb, 1995)
- [4] M. Takahashi, "Compatibility for optical connectors with different slanted angles at their ferrule endfaces," Proc, IEEE CLEO / Pacific Rim'95, pp. 304. (July, 1995)
- [5] 高橋光雄, "斜め球面研磨光コネクタの接続端面角度差異による互換性"日本電子部品信頼性センタ、RCJ 第4回電子デバイスの信頼性シンポジューム、pp. 39 45, (11, 1995)
- [6] "技術指導資料: FC Type Fiber Optic Connector 図面," NTT アドバンステクノロジー株式会社, 1986.
- [7] "技術指導資料: SC Type Fiber Optic Connector 図面," NTT アドバンステクノロジー株式会社, 1989.
- [8] International Electrotechnical Commission, "INTERNATIONAL STANDARD IEC-874-14-16. DETAIL SPECIFICATION FOR FIBRE OPTIC CONNECTOR TYPE SC-APC TUNED 9 DEGREES FOR SINGLE MODE FIBRE TYPE," Published in May, 1997.
- [9] International Electrotechnical Commission, "INTERNATIONAL STANDARD IEC-874-14-XX. "DETAIL SPECIFICATION FOR FIBRE OPTIC CONNEC-TOR TYPE SC-APC TUNED 8 DEGREES FOR SINGLE MODE FIBRE TYPE," To be published by the end of 1997.
- [10] "SP-500 POLISHING MACHINE OPERATION MANUAL," Siecor Co., LTD, Feb, 1997.
- [12] "APM Polishing Machine Operating Instruction," Domaille Engineering, INC, 1997.

- [13] "OFL12 シリーズ研磨機取扱説明書," セイコー電子工業株式会社, No. 39NPM-53EI-01, 1997.
- [14] M. Takahashi, "Elastic Polishing Plate Method and Conditions for Forming Angled Convex Surface on Ferrule Endface," IEEE Journal of Lightwave Technology. Vol. 15, No. 9, pp. 1675 - 1680, 1997.
- [15] 機械設計便覧編纂委員会, "機械設計便覧," 丸善株式会社.pp.1872, 1973.
- [16] New-Port Catalogue, New-Port Co., LTD. pp. J-23, 1990.
- [17] 鈴木,他, "光コネクタ損失特性の端面処理効果,"昭56年度信学 全大, No. 2256, 1981.
- [18] D. Marcuse, "Loss Analysis of Single-Mode Fiber Splices," Bell System Tech' Journal, Vol. 56, No. 5, p. 713, 1977.
- [19] M. Takahashi, "Variable Light Attenuator of Improved Air-gap Type with Extremely Low Returning Light," Proc, IEEE IMTC/94, Vol. 2, pp. 947-950, (May. 1994).

第6章 APCコネクタの挿入損失の実験

6.1 まえがき

第6章では,第4章及び第5章で形状特性及び接続特性の理論解析を 行った,テーパ・フェルール付きAPCコネクタとステップ・フェルー ル付きAPCコネクタについて,つぎの3項目について挿入損失の実験 を行った.

1) フェルールの形状及び回転角度による挿入損失

初めに、フェルールの回転を伴う実際の接続状態において、挿入損失 の変化を確認する. 第3章及び第4章において理論解析を行ったテー パ・フェルール、及び第5章で新しく提案し、理論解析を行ったステッ プ・フェルールを対象とする. 各FC/APCコネクタは、表4.1 (a) に示した従来の許容回転角度を16度にしたFC/PCコネクタ用部品 にテーパ・フェルールを組み込み、新しく提案した許容回転角度を4度 にした表5.2 (a) に示すFC/APCコネクタ用部品にステップ・フェ ルールを組み込んで構成した、実験では、フェルール回転角度 φを変え て挿入損失の変化を比較した[1],[2].

2) フェルールの回転角度と増加挿入損失

次に、フェルールの回転角度が0度における初期挿入損失に対して、 フェルールが10度まで回転した場合の挿入損失の増加の状態を調査す ることを目的として、フェルールの回転角度を1度おきに回転させて 各々のフェルール回転角度における挿入損失の増加を測定する実験を 行った.測定試料として、第5章で新しく提案した表5.2(a)に示すF C/APCコネクタ用部品に、ステップ・フェルールを組み込んで構成 したAPCコネクタを使用した[3].

3) 繰り返し着脱特性

最後に、フェルールの先端形状の差異、及びコネクタ部品によるフェ ルール回転角度φに起因した挿入損失の接続安定性を確認することを目 的として、テーパ・フェルール及びステップ・フェルールを各々組み込 んで構成したFC/APCコネクタについて、50 サイクルの繰り返し 着脱の実験を行った.

6.2 フェルールの形状及び回転角度による挿入損失の比較

前述のフェルールの形状及び回転角度による挿入損失を調査するため に、次のようにして実験を行った.

6.2.1 実験試料及び実験方法

1) 実験試料

1.1) 光ファイバ

光ファイバは、長さ3メートルのシングルモード光フアイバ (SMF9 /125)、及び分散シフト光ファイバ (DSF8 / 125)を使用した.ここ で、シングルモード光フアイバは、斜め球面の傾斜角度 θ_1 =8度のAP Cコネクタに使用し、分散シフト光ファイバは斜め球面の傾斜角度 θ_1 = 12度のAPCコネクタに使用した.

1.2) フェルール材質と接着条件

図3.1 (a)に示したジルコニア・セラミック製のFC/PCコネクタ 用テーパ・フェルール,及び図5.1 (a) に示したジルコニア・セラミッ ク製FCコネクタ互換型ステップ・フェルールの中心孔に,各々上記の 長さ3メートルのシングルモード光フアイバ,または分散シフト光ファ イバをエポキシ接着剤で各々接着固定して使用した.エポキシ接着剤の キュアリング温度は各々110 ℃,キュアリング時間は各々30分に設定 して行った.

1.3) フェルールの曲率半径及び傾斜角度

各々のフェルールの斜め球面の曲率半径は,5 mmから12.5 mmの 範囲のものをランダムに選択して使用した.フェルール端面の斜め球面 の傾斜角度 *θ*,は12度及び8度の2種類とした.

1.4) コネクタ部品

コネクタ部品は,表4.1 (a) に示す従来のFC/PCコネクタ用部 品,及び新しく提案した表5.2(a) に示すFC/APCコネクタ用部品 の2種類を使用した.従って,接続時のフェルール間の最大回転角度 φ



は、各々16度及び4度である.これらのコネクタ部品に各々のフェル -ルを組み込んで測定試料とした.

1.5) 測定試料数

試料数は、各々のグループ毎に11本(合計44本)を製作した。

2) 測定法

2.1) 測定器及び光源波長

図 6.1 に測定装置の写真を示す. 測定光源として, この測定装置には 波長 λ = 1.310 µm と λ = 1.550 µm の2種類の レーザ光源, 及びパ ワーメータが各々内蔵されている[4].

斜め球面の傾斜角度 θ_1 が12度の分散シフト光ファイバの試料には測 定波長 λ =1.550 μ mの光源を使用した. 斜め球面の傾斜角度 θ_1 が8度 のシングルモード光フアイバの試料には測定波長 λ =1.310 μ mの光源



(a). Setup procedure for reference of zero dB.



(b). Procedure for measurement of insertion loss.
 図 6.2 挿入損失の手順のダイアグラム

を使用した.

2.2) 試料の接続法

挿入損失の測定方法は、JISでは、マスターコネクタコードによる方 法が定められているが、本論文では、実際の接続状態を再現するため に、ランダムに各々のコネクタを接続する方法により測定した[5]. 従って、マスタコネクタコードを使用した挿入損失よりも若干大きな測 定値になる.

2.3) 測定法

挿入損失の測定法を図 6.2 (a),(b) に示す. 図 6.2 (a) は,パワー メータの零 dBの測定基準調節の説明図である.長さ3メートルの光 ファイバ・コードの両端に取付けたAPCコネクタを,各々光源及びパ ワーメータに接続した状態で,パワーメータの読みを零dBに調節する. 図 6.2 (b) は, 挿入損失の測定手順の説明図である. 試料のコネクタ付 き光ファイバ・コードとして, 光源側接続用として, 記号 1,2,3,4,及 び5の5本使用する. 一方, パワーメータ側には, A-1/A-2, B-1/B-2, C-1/C-2, D-1/D-2, E-1/E-2, 及びF-1/F-2の6本のコネク 夕付き光ファイバ・コードを使用する.

測定の一例として、コネクタ1にA-1を接続して、コネクタ1とコ ネクタA-1の間の挿入損失を測定する.次に、パワーメータ側のコネク タ付き光ファイバ・コードA-1/A-2反対に取付けて、コネクタ1とコ ネクタA-2の間の挿入損失を測定する.このようにして、順次に、B-1/B-2、C-1/C-2、D-1/D-2、E-1/E-2、及びF-1/F-2のコネク タ付き光ファイバ・コードを取付けて、各々コネクタ1との間の挿入損 失を測定する.次に、光源側のコネクタ付き光ファイバ・コード2を取 付けて、同様に挿入損失を測定する.このようにして、1グループにつ き 60 組の接続の挿入損失値が得られる.

6.2.2 実験データ

1) テーパ・フェルール付きAPCコネクタの挿入損失

図 6.3 に、フェルールの回転角度 $\varphi < 16$ 度、及び $\varphi < 4$ 度のコネク タ部品に組み込んだ、斜め球面の傾斜角度 $\theta_1 = 12$ 度のテーパ・フェルー ル付き APCコネクタの挿入損失のヒストグラムを示す。前述のよう に、本試料には分散シフト光ファイバを使用している。図6.3から、フェ ルール回転角度 $\varphi < 16$ 度のコネクタ部品に組み込んだ、テーパ・フェ ルール付き APCコネクタの挿入損失の偏差は、 $\overline{X} \pm 3\sigma = 1.038 \pm$ 0.516 dBとなった。一方、フェルール回転角度 $\varphi < 4$ 度のコネクタ部 品に組み込んだ場合の、テーパ・フェルール付き APCコネクタの挿入 損失の偏差は、 $\overline{X} \pm 3\sigma = 0.720 \pm 0.366$ dBとなり、挿入損失の偏差 の最大値は1.818 dBとなり、フェルールの回転角度 φ の規制効果には 多少の改善は認められる。

図 6.4 に、フェルールの回転角度 $\varphi < 16$ 度、及び $\varphi < 4$ 度のコネク 夕部品に組み込んだ、斜め球面の傾斜角度 $\theta_1 = 8$ 度のテーパ・フェルー



図 6.3 回転角度 $\varphi < 16$ 度,及び $\varphi < 4$ 度,傾斜角度 $\theta_1 = 12$ 度の テーパ・フェルール付き APCコネクタの挿入損失 *IL*

ル付き APCコネクタの挿入損失のヒストグラムを示す、本試料にはシ ングルモード光フアイバを使用している.図6.4から,フェルール回転 角度 φ<16 度のコネクタ部品に組み込んだ,テーパ・フェルール付き APCコネクタの挿入損失の偏差は, X±3σ=0.383±0.636 dBと



図 6.4 回転角度 $\varphi < 16$ 度,及び $\varphi < 4$ 度,傾斜角度 $\theta_1 = 8$ 度の テーパ・フェルール付き APCコネクタの挿入損失 IL

なった. 一方,フェルール回転角度 $\varphi < 4$ 度のコネクタ部品に組み込ん だ場合の,テーパ・フェルール付きAPCコネクタの挿入損失の偏差 は, $\overline{X} \pm 3\sigma = 0.230 \pm 0.417$ dB であった

2) ステップ・フェルール付きAPCコネクタの挿入損失



図 6.5 回転角度 $\varphi < 16$ 度,及び $\varphi < 4$ 度,傾斜角度 $\theta_1 = 12$ 度の ステップ・フェルール付き APCコネクタの挿入損失 *IL*

図 6.5 に、フェルールの回転角度 $\varphi < 16$ 度、及び $\varphi < 4$ 度のコネク タ部品に組み込んだ、斜め球面の傾斜角度 $\theta_1 = 12$ 度のステップ・フェ ルール付き APCコネクタの挿入損失のヒストグラムを示す. 図6.5か ら、フェルール回転角度 $\varphi < 16$ 度のコネクタ部品に組み込んだ、ステッ



図 6.6 回転角度 $\varphi < 16$ 度,及び $\varphi < 4$ 度,傾斜角度 $\theta_I = 8$ 度の ステップ・フェルール付き APCコネクタの挿入損失 *IL*

プ・フェルール付きAPCコネクタの挿入損失の偏差は、 $\overline{X} \pm 3\sigma = 0.25 \pm 0.45$ dBとなった.一方、フェルール回転角度 $\varphi < 4$ 度のコネクタ部品に組み込んだ場合の、ステップ・フェルール付きAPCコネクタの挿入損失の偏差は、 $\overline{X} \pm 3\sigma = 0.178 \pm 0.378$ dBであった.

図 6.6 に、フェルールの回転角度 φ <16 度、及び φ <4 度のコネク タ部品に組み込んだ、斜め球面の傾斜角度 θ_I =8度のステップ・フェル ール付き APCコネクタの挿入損失のヒストグラムを示す。図 6.6 か ら、フェルール回転角度 φ <16度のコネクタ部品に組み込んだ、ステッ プ・フェルール付きAPCコネクタの挿入損失の偏差は、又 ± 3 σ = 0.182 ± 0.351 dBとなった。一方、フェルール回転角度 φ <4度のコ ネクタ部品に組み込んだ場合の、ステップ・フェルール付きAPCコネ クタの挿入損失の偏差は、又 ± 3 σ = 0.147 ± 0.228 dBであった。

6.2.3 実験結果と考察

図 6.7 は、フェルールの回転角度 $\varphi < 16 度$ 、及び $\varphi < 4 度$ のコネク タ部品に組 み込んだ、斜め球面の傾斜角度 $\theta_1 = 12 度及び \theta_1 = 8 度の$ テーパ・フェルール付きAPCコネクタ及びステップ・フェルール付き AP Cコネクタの挿入損失の偏差の要約図を示す.図 6.7 から、実験 結果は次のように要約できる.

挿入損失の偏差

図 6.7 から, テーパ・フェルール付きAPCコネクタの場合は, フェ ルールの斜め球面の傾斜角度 $\theta_1 = 12$ 度及び $\theta_1 = 8$ 度における挿入損失 の中心値 \overline{X} は,フェルールの回転角度 φ を16度から4度に規制したコ ネクタ部品を使用することによって改善できる.特に,挿入損失の偏差 σ の改善効果は大きいことが判る.それでも,最大挿入損失の目標値を 0.5 dBと仮定すれば,斜め球面の傾斜角度 $\theta_1 = 12$ 度のテーパ・フェ ルール付きAPCコネクタの場合,正規確率紙により求めた合格率は約 25%になる[6].一方,フェルールの斜め球面の傾斜角度 $\theta_1 = 8^\circ$ のテ -パ・フェルール付きAPCコネクタの合格率は約97.5%になり,2.5 %の不良率になる.

図6.7から、ステップ・フェルール付きAPCコネクタの場合は、フェ ルールの斜め球面の傾斜角度 $\theta_1 = 12$ 度及び $\theta_1 = 8$ 度における挿入損失 の中心値 \overline{X} は、フェルールの回転角度 φ を16度のコネクタ部品を使用 した場合においてもも、テーパ・フェルール付きAPCコネクタに比較



図 6.7 回転角度 $\varphi < 16$ 度,及び $\varphi < 4$ 度,傾斜角度 $\theta_1 = 12$ 度及び $\theta_1 = 8$ 度のテーパ・フェルール付きAPCコネクタ及びステップ・フェルール付き APCコネクタの挿入損失 *IL*の偏差

して十分に小さい.フェルールの回転角度φを4度に規制したコネクタ 部品を使用した場合も,挿入損失 ILの低減効果は.テーパ・フェルー ル付きAPCコネクタに比較して顕著ではない.最大挿入損失の目標値 を0.5 dBと仮定すれば,フェルールの斜め球面の傾斜角度 θ₁ = 12 度



図 6.8 斜め球面の傾斜角度 $\theta_1 = 12$ 度における,テーパ・フェルー ル付き APCコネクタとステップ・フェルール付きAPCコ ネクタのフェルール回転角度 φ と所要接触力 W

のステップ・フェルール付きAPCコネクタの場合,正規確率紙により 求めた合格率は約99.5%になる.一方,フェルールの斜め球面の傾斜 角度 $\theta_1 = 8 \mod \pi$ ・フェルール付きAPCコネクタの合格率は約 100%になる.

2) 曲率半径の差異と挿入損失

第4章に記述したように、テーパ・フェルール付きAPCコネクタの 場合は、一対のフェルールの斜め球面の曲率半径 $R_1 \ge R_2$ に差異がある ときには、斜め球面の接点 Q_c の光軸ZZからの偏心のyy座標 e_{cy} の値 が大きくなり、そのために、光ファイバ端面間のエアギャップ Z_c の消 去に要する接触力 W_c は、フェルールの回転角度 φ が0度においても大 きな値になる.

一方,ステップ・フェルール付きAPCコネクタの場合は,第5章に 記述したように,一対のフェルールの斜め球面の曲率半径*R*₁と*R*₂に差



図 6.9 斜め球面の傾斜角度 $\theta_1 = 8$ 度における,テーパ・フェルール 付き APCコネクタとステップ・フェルール付きAPCコネ クタのフェルール回転角度 φ と所要接触力 W

異があるときでも、斜め球面の接点 Q_s の光軸ZZからの偏心のyy座標 e_{sy} の値は無視できる程度に小さい、従って、光ファイバ端面間のエア ギャップ Z_s の消去に要する接触力 W_s は、フェルールの回転角度 φ が0 度においては近似的に0 kgfになる.

図 6.8 及び図 6.9 は、斜め球面の傾斜角度 θ_1 が 12 度及び 8 度のテー パ・フェルール付きAPCコネクタとステップ・フェルール付きAPC コネクタについて、各々のフェルール 2 の斜め球面の曲率半径 R_2 が 5 mmに固定し、フェルール1の斜め球面の曲率半径 R_1 が 12.5 mm、10 mm及び 7.5 mmに変化させた場合に、フェルールの回転角度 φ が各々 0 度から 10 度まで 2 度おきに変化したときの、光ファイバ端面間のエ アギャップの消去に要する接触力Wの理論計算値をプロットしたもので ある.

図 6.8 及び図 6.9 から、コネクタ・プラグに内臓された圧縮コイルば

ねの有効接触力 $W_o \ge 0.7 \ \text{kgf} \ge \text{truit}$, 光ファイバ端面間のエア ギャップの消去に要する接触力 W_c が $W_o = 0.7 \ \text{kgf}$ よりも大きな領域 では光ファイバ端面間のエアギャップは消去できない.図 6.3 から図 6.7に示したフェルール回転角度 φ による挿入損失*IL*の比較実験結果で は、テーパ・フェルール付きAPCコネクタの挿入損失の値に対して、 ステップ・フェルール付きAPCコネクタの挿入損失*IL*の値が全般的 に小さな値を示すが、図 6.8 から図 6.9 はこの根拠を示している.

3) エアギャップと挿入損失

A P C コネクタの接続時の挿入損失の構成要素としては,第1章において,式(1.1)から(1.5)について概要を述べたように,整列アダプタにフェルールを挿入して接続したときの,光ファイバ間の光軸の偏心による光損失IL_dなどの機械的な要因のほか,一対の光ファイバの端面が密着しない場合,光ファイバと空気層の光屈折率差異によるフレネル損失IL_F,エァギャップが光波長λのλ/4になる毎に増減する光ファイバ端面間の多重反射による光損失IL_R,及び光ファイバ端面間に距離による光の減衰IL_Aなどが挙げられる.最終的に,これらの挿入損失の構成要素による光損失の累積されたものが挿入損失ILとして表われる.

図 6.10 及び図 6.11 は、テーパ・フェルール付きAPCコネクタ、及 びステップ・フェルール付きAPCコネクタについて、斜め球面の傾斜 角度 $\theta_i = 12$ 度及び $\theta_i = 8$ 度における、フェルールの回転角度 φ と挿入 損失 *IL*の関係を式 (1.2) から式 (1.4) にもとずいて計算した値を合 算してプロットしたものである.

図 6.10 及び図 6.11 において,挿入損失 ILの0 dBは, コネクタプ ラグに内蔵された圧縮コイルばねによる接触力W₀を0.7 kgfのときの エァギャップを零として,第4章及び第5章に示した各々図4.9及び図 5.10 のエァギャップの図から求めた.前述のように,挿入損失 ILは必 ずしもフェルールの回転角度 φには比例しないことが図 6.10 及び図 6.11 は示している.

ここで、図 6.10 に示したテーパ・フェルールの場合,一対のフェル ール端面の斜め球面の曲率半径が異なる組合せの場合は,フェルール回

170





転角度 φ <6度の領域において,斜め球面の接点 Q_c の光軸ZZからの偏 心の yy 座標成分 e_{cy} によりエァギャップ Z_c を消去できない.従って, テーパ・フェルール付きAPCコネクタのエァギャップ Z_c による挿入 損失ILがステップ・フェルール付きAPCコネクタの挿入損失ILより


図 6.11 傾斜角度 θ₁が 12 度及び 8 度のステップ・フェルールの回転 角度 φ と挿入損失 *IL*

大きくなる原因と考えられる.

図 6.10 及び図 6.11 によれば,挿入損失 ILのプロットは山と谷が不 規則に連続しているが,これは,光ファイバ間のエァギャップZが,光 波長λのλ/4になる毎に増減する光ファイバ端面間の多重反射 IL_Rに よる 0.6 dB に及ぶ光損失の影響によると考えられる.

光ファイバ端面間にエァギャップ2が生じた場合は,テーパ・フェ ルール付きAPCコネクタ及びステップ・フェルール付きAPCコネク タは,共に挿入損失ILの増加は避けられないことを図6.10及び図6.11 は示している.

6.3 ステップ・フェルールの回転角度と増加挿入損失

本節では、ステップ・フェルールの回転角度 φ と挿入損失の変化の相関性を詳細に調査することを目的として、第5章で新しく提案した表 5.2 (a) に示すFC/APCコネクタ用部品に、ステップ・フェルール を組み込んで構成したAPCコネクタについて、フェルールの斜め球面 の傾斜角度 θ_1 ,曲率半径 R_1 , R_2 をパラメータとして、フェルール回転 角度 φ と挿入損失の増加に関する実験を行った[7],[8].

6.3.1 実験試料と実験方法

1) 測定項目

ステップ・フェルールの端面傾斜角度 θ_1 が8度及び12度,曲率半径 $R_1 \geq R_2$ の組合せが,各々12.5 mm対12.5 mm,12.5 mm対5 mm, 及び5 mm対5 mmについて,ステップ・フェルール2の回転角度 φ の変化に対応する挿入損失の増加を測定した.すなわち,ステップ・ フェルール2の回転角度が0度における初期挿入損失値 IL_1 に対して, フェルール回転角度 φ が1度おきに10度まで増加した時の各回転角度 φ における挿入損失 IL_2 を測定して,次の式(6.1)により挿入損失の増加 加 ΔIL を計算により求めた.

 $\Delta IL = IL_2 - IL_1 \tag{6.1}$

図 6.12は、今回の実験に測定治具として使用した整列アダプタを示 す. すなわち、整列アダプタの一端の整列キー溝1の位置に対して、他 端側の整列キー溝2を、0度から10度まで1度間隔に円周方向にΔず つ、ずらした位置に設けた整列アダプタを各1個、合計11個製作した. 測定では、整列アダプタの左側に、基準となるFC/APCコネクタ



図 6.12 測定治具として使用した整列アダプタ

を取り付け, 整列アダプタの右端側に供試 F C / A P C コネクタを1個 ずつ順次交換して取り付けて, 挿入損失を測定した. なお, 測定光源に は光波長 λ=1.310 μm の半導体レーザを使用した.

2) 供試FC/APCコネクタ部品仕様

2.1) ステップ・フェルールの曲率半径

各傾斜角度 θ₁ が 8 度及び 12 度について,斜め球面の曲率半径 12.5 ± 0.5 mm,及び 5 ± 0.5 mm の精度範囲のステップ・フェルールを 各 10 個,合計 40 個を使用した.

2.2) コネクタプラグ

ステップ・フェルールのフランジに設けられた整列キー溝幅と, FC コネクタプラグの整列キー幅の間の隙間が, 0.02 mm以下の精度範囲 のもの(定偏波光ファイバ用)を所要数製作して使用した(自由回転角 度±0.34度以下).

2.3) 整列アダプタ

FCコネクタプラグの整列キー直径との隙間が0.02 mm以下の整列 キー溝幅のものを,前述のように各1個,合計11個製作して使用した (自由回転角度±0.15度以下).整列スリーブ材質は燐青銅製FCコネ クタ用標準スリーブを使用した.

2.4) ばね仕様

接続時の、ばね圧力 $W_a = 0.7 \pm 0.2 \text{ kgf}$ のFCコネクタ用標準コイ

<第6章>



図 6.13 斜め球面の傾斜角度 θ₁が 12 度のステップ・フェルール の回転角度 φと挿入損失の増加 ΔIL,及び計算による 挿入損失 IL

ルばねを使用した.

6.3.2 実験データ

図 6.13 (a)に, 各傾斜角度 θ_1 が 12度のステップ・フェルールについ



図 6.14 斜め球面の傾斜角度 θ₁ が 8 度のステップ・フェルール の回転角度 φと挿入損失の増加 ΔIL, 及び計算による 挿入損失 IL

て,ステップ・フェルール2の回転角度φを0度から10度まで1度お きに変化させた時に,回転角度φ=0度における初期挿入損失に対し て,各回転角度における増加挿入損失 ΔIL の平均実測値をプロットし たものである.図6.13(b)は,前述の図6.11(a)に示した挿入損失の 理論計算値を,実験値との比較のために再度示したものである.

図 6.14 (a)に、各傾斜角度 θ_1 が 8 度のステップ・フェルールについ て、ステップ・フェルール 2 の回転角度 φ を 0 度から 10 度まで 1 度お きに変化させた時に、回転角度 φ = 0 度における初期挿入損失 IL_1 に対 して、各回転角度における増加挿入損失 ΔIL の平均実測値をプロット したものである.図 6.14 (b) は、前述の図 6.11(b)に示した挿入損失 ILの理論計算値を、実験値との比較のために再度示したものである.

ここで、図 6.13 (a) と図 6.14 (a) の増加挿入損失 ΔIL の平均実 測値は、式 (6.1) で述べたように、回転角度 $\varphi = 0$ 度における挿入損 失値 IL_1 の初期値を 0 dBとして図示しているが、図 6.13 (b) と図 6.14 (b) の挿入損失の計算値 ILは以上の初期値を含んで示している。

6.3.3 実験結果と考察

ステップ・フェルールの回転角度φが10度以内の場合,APCコネ クタの増加挿入損失 ΔIL の実験結果については,次のように考察でき る.

1) 増加挿入損失 AIL の実測値と理論値の差異

図6.13及び図6.14では、フェルール回転による増加挿入損失ΔILの 実験値のプロットを、計算で求めた挿入損失ILのプロットと比較する と、増加挿入損失ΔILの実験値の増加しはじめるフェルールの回転角度 φは、計算で求めた挿入損失ILの増加しはじめるフェルールの回転角度 φに極めて近似している.

一方,増加挿入損失 ΔILの実験値は,計算で求めた挿入損失 ILの値 よりも平均して 0.2 dB から 0.3 dB 程度の小さな値ではあるが差異が 認められる.この理由としては,上述の増加挿入損失 ΔILの初期値 IL₁ を 0 dB とおいてプロットして いるからである.

2) フェルール形状による増加挿入損失 AIL

今回は,ステップ・フェルール付きAPCコネクタについて増加挿入 損失 *ΔIL*の実験を行ったが,テーパ・フェルール付きAPCコネクタの 場合も、同様なフェルールの回転角度 φと挿入損失の増加 ΔILの関係が あると考えられる.ただし、テーパ・フェルール付きAPCコネクタの 場合は、一対のテーパ・フェルール端面の曲率半径 R₁、R₂が異なる場 合は、フェルールの回転角度 φが0度から増加挿入損失 ΔILがはじまる ことが前述の図 6.10 から判る.従って、ステップ・フェルール付きA PCコネクタに比較して、テーパ・フェルール付きAPCコネクタの挿 入損失 ILは全般的に大きくなる.

6.4 繰り返し着脱

フェルールの先端形状,及びコネクタ部品によるフェルール回転角度 φによる挿入損失 IL の安定性を確認することを目的として,テーパ・ フェルール及びステップ・フェルールを,各々組み込んで構成したFC /APCコネクタについて,50サイクルの繰り返し着脱の実験を行っ た.

6.4.1 実験試料及び実験方法

1.1) 光ファイバ

光ファイバは、前述の実験と同様のものを使用した.

1.2) フェルールの曲率半径及び傾斜角度

各々のフェルールの斜め球面の曲率半径は,5 mmから12.5 mmの 範囲のものをランダムに選択して使用した.フェルール端面の斜め球面 の傾斜角度は12度及び8度の2種類とした.

1.3) コネクタ部品

コネクタ部品は,表4.1 (a) に示す従来のFC/PCコネクタ用部 品,及び新しく提案した表5.2(a) に示すFC/APCコネクタ用部品 の2種類を使用した.従って,接続時のフェルール間の最大回転角度 φ は,各々16度及び4度である.これらのコネクタ部品に各々のフェル ールを組み込んで測定試料とした.

1.4) 測定試料数

試料数は,各々のグループ毎に2本(合計8本)を製作した.(各グ



ループ毎に接続を変えることにより,各グループ毎に4組のデータが得られる).

2) 測定法

2.1) 測定器及び光源波長

図 6.1 に示した測定装置を使用した[3]. 測定光源として, この測定 装置には波長λ=1.310 μm とλ=1.550 μm の2種類の レーザ光源, 及びパワーメータが内蔵されている. ここでは, 波長λ=1.310 μm の 光源を使用した.

2.2) 試料の測定法

挿入損失の測定方法は、JISに準拠した.繰り返し着脱の回数は50回 とした.JISの繰り返し着脱試験の規格としては、測定前の挿入損失値 に対して、繰り返し着脱試験後の挿入損失の変動値が0.2 dB以下に規 定されている[4].

6.4.2 実験結果と考察

図 6.15 に実験データの一例を示す.図 6.15 では,繰り返し着脱試験の間における最大挿入損失値と最小挿入損失値のばらつき値 *IL_{max}*,及び繰り返し着脱試験の前後の挿入損失の変化 (Δ*IL*=*IL₀-IL₅₀)を示してある*,

繰り返し着脱実験結果を要約した結果を表 6.1 に示す.表 6.1 では, フェルールの斜め球面の傾斜角度θが,各々 12 度及び 8 度,及びフェ

表 6.1 繰り返し着脱の実験データ

Ferrule & connector $\theta = 12$ degrees	Maximum variation IL _{max} while testing	Averaged change of insertion loss ΔIL at
		initial and final stages
1. Tapered-ferrule		
Ferrule rotation		
φ <16 degrees	0.47 dB	0.16 dB
φ < 4 degrees	0.39	0.13
2. Stepped-ferrule		
φ <16 degrees	0.13	0.09
φ < 4 degrees	0.09	0.05

(a). $\theta_1 = 12$ degrees.

(b). $\theta_1 = 8$ degrees.

Ferrule & connector $\theta = 8$ degrees	Maximum variation IL _{max} while testing	Averaged change of insertion loss ΔIL at initial and final strategy ΔIL
1 Tapered_ferrule		initial and innai stages
Formula notation		
Ferrule rotation		
φ <16 degrees	0.48 dB	0.06 dB
$\varphi < 4$ degrees	0.39	0.04
2. Stepped-ferrule		
φ <16 degrees	0.20	0.09
$\varphi < 4$ degrees	0.07	0.07

ルールの回転角度が、各々 φ <16度、及び4度のコネクタ部品を使用 した場合の、テーパ・フェルール付きAPCコネクタ及びステップ・ フェルール付きAPCコネクタの、繰り返し着脱試験の間における最大 挿入損失値と最小挿入損失値のばらつき値 IL_{max} ,及び繰り返し着脱試 験の前後の挿入損失の変化 ($\Delta IL=IL_0-IL_{50}$)を示してある、図 6.1 では、 フェルールの回転角度 φ の大きいほうが、テーパ・フェルール及びス テップ・フェルールに無関係に、ばらつき値 IL_{max} ,及び挿入損失の変 化 ΔIL の値は大きくなる。従って、新たに提案したコネクタ部品を使用 したAPCコネクタは接続安定性の視点で従来のPCコネクタ部品を使 用したAPCコネクタに比較して優れている.

6.5 まとめ

第6章では,第3章から第5章に記述したテーパ・フェルール付きA PCコネクタ及びステップ・フェルール付きAPCコネクタの接続特性 の理論解析の結果を検証するために,次の3項目について実験を行った.

(a) フェルールの先端形状及び回転角度 gによる挿入損失 IL

(b) フェルールの回転角度 φと増加挿入損失 AIL

(c) 繰り返し着脱特性

その結果は次のように要約できる.

1) フェルールの先端形状及び回転角度 φ による挿入損失 L

テーパ・フェルール付きAPCコネクタの挿入損失 *IL*が大きな値を 示す要因として、曲率半径 R_1 , R_2 に差異がある場合、フェルールの回 転角度 φ が0度においても接触力 W_c が大きくなり、ばね力 W_o では密 着しない確率が増加することによる.

フェルールの回転角度 φと増加挿入損失 L

実験値の方が理論値より約0.2 dB 程度の良い数値を示しているが, この理由としては,実験値は初期値を0 dBとして計算したからである. その他の理由としては,石英ガラス製光ファイバのヤング率はジルコニ ア・フェルールの約1/2と小さいので弾性変形し易く,光ファイバの 半径より小さい領域を含めた接触力を考慮した場合,光ファイバ端面間 の密着させる接触力が小さめになることが考えられる.これらの要素を 考慮した場合,増加挿入損失ΔILの実験データは理論計算式から求めた 挿入損失 IL の値にほぼ一致していると結論できる.

3) 繰り返し着脱特性

繰り返し着脱試験による挿入損失ILのばらつき値IL_{max},及び挿入損 失の変化ΔILの値は、フェルールの回転角度φが大きくなるほど増加す る. 一方, ステップ・フェルール付きAPCコネクタの挿入損失のばら つき値 *IL_{max}*, 及び挿入損失の変化 *ΔIL*の値は, テーパ・フェルール付 きAPCコネクタの値に比較して小さい値を示す.

以上の挿入損失に関する実験結果から,更に次のように再要約できる.

I) ステップ・フェルール付きAPCコネクタの挿入損失特性は, テーパ・フェルール付きAPCコネクタに比較して優れている.

Ⅱ) 挿入損失特性及び安定性は、回転角度を規制したコネクタ部品 を使用したAPCコネクタの方が優れている.

第6章参考文献

- [1] M. Takahashi, "Experimental Considerations for APC Optical Connectors with Slanted Angle of 8 degrees," Reports of The Graduate School of Electronic Science and Technology of Shizuoka Univ., Vol. 17, pp.89-95. 1996.
- [2] M. Takahashi, "Novel stepped-ferrule for angled convex polished optical fiber connector," Proc, OFC'95, San Diego, Technical Digest, pp. 184-185, 1995.
- [3] "Instruction manual for RM-3000," JDS Fitel INC, 1995.
- [4] "JIS C5961-1987, Test Methods for Connectors for Optical Fiber Cords," Japanese Industrial Standards Committee, 1987.
- [5] "JIS C9041-1968, Quality Control," Japanese Industrial Standards Committee, 1968.
- [6] 高橋光雄、"斜め球面接続光コネクタ用ステップ・フェルールの
 回転ずれによる挿入損失の増加、"電子情報通信学会論文誌Cー
 II、(1997年8月投稿)
- [7] M. Takahashi, "Connections of APC Optical Connectors with Stepped-Ferrules," IEEE, Journal of Lightwave Technology. (Submitted in August 1997. Assigned No. 3610)

第7章 結 言

7.1 本論文のまとめ

本研究では、シングルモ-ド光ファイバ用光コネクタの実用化の前提 となっていた、光ファイバ端面の斜め球面研磨装置に関する研究に関し ては、公転と自転の複合円軌跡運動をする弾性研磨盤に、固定保持した 光ファイバ付きフェルールを押し付けて行う新しい光ファイバ端面の斜 め球面成形研磨法について提案し、新しい研磨装置の概要と特徴につい て記述した.次に、本研磨装置により成形された光ファイバ端面の斜め 球面に関して理論的検討を加え、更に、評価実験から得られた斜め球面 成形研磨の特性について記述した.

APCコネクタの挿入損失の改善に関する研究に関しては、最初に、 テーパ・フェルールについて、斜め球面の形状特性、及び接続特性を理 論解析した.その解析結果によってAPCコネクタ用フェルールの接続 特性の改善に関する課題を明らかした.その課題を解決するために、A PCコネクタ用フェルールとして、フェルール先端部を段付き直円筒に 成形した新しいステップ・フェルール(Stepped-ferrule)を提案し、 その形状特性と接続特性の理論解析を行なうと共に、接続実験のデータ からステップ・フェルール付きAPCコネクタの優位性を明らかにし た.

更に,フェルール回転角度による挿入損失の増加を規制するために, 新しい光コネクタの構成部品を提案し,挿入損失の実験によって,その 有効性を明らかにした.以下に,本研究の主な内容及び特徴を要約す る.

7.1.1 斜め球面成形研磨成形装置

第2章では,最初に,APCコネクタの大量生産に不可欠な,フェルー ル端面の球面成形研磨装置を提案し,併せて本球面成形研磨装置による 研磨特性の評価実験を行って,球面成形の研磨メカニズムを明らかにし た.その結果は次のように要約できる. 1) 公転と自転の複合円軌跡運動をする弾性研磨盤に,固定保持した 光ファイバ付きフェルールを押し付けて研磨を行う,新しい光ファイバ 端面の斜め球面成形研磨装置は,実用上必要な機械特性及び光学特性を 具備していることを実験データにより明らかにした.

2) フェルール端面の研磨球面の曲率半径Rは、フェルール端面の弾 性研磨盤面への埋没深さhと、フェルール先端部の半径bとにより一意 的に決定されることを実験的に示した.

3) 本研究による斜め球面成形研磨 装置には球面の成形限界がある. ただし、フェルール先端部の半径 b が 0.3 mm 以上の場合、または弾 性研磨盤の硬さ Hs が 95 以下の場合には、本論文の球面研磨法を適用 できることを実験的に証明できた.

7.1.2 APCコネクタの接続特性

第3章では、APCコネクタに関する基本的な課題を明らかにするために、フェルール回転角度 $\varphi = 0$ 度において、テーパ・フェルールの端面傾斜角度 θ_1 、及び斜め球面の曲率半径 $R_1 \ge R_2 \le R_2 \ge R_2 \le R_2 \ge R_2 \le R_2 \le R_2 \ge R_2 \le R_2 \le R_2 \ge R_2 \le R_2 \le R_2 \le R_2 \le R_2 \le R_2 \le R_2 \ge R_2 \le R_2 \le R_2 \le R_2 \le R_2 \le R_2 \le R_2 \ge R_2 \ge R_2 \ge R_2 \le R_2 \le R_2 \le R_2 \ge R_2 \le R_2 \ge R_2 \ge R_2 \ge R_2 \ge R_2 \ge R_2 \le R_2 \ge R_2 \le R_2 \le$

1) APCコネクタにおいて, 斜め球面頂点 P_c の光軸ZZに対する偏 心 S_c , 接続時の各々フェルールの接点 Q_c の光軸ZZに対する偏心 e_c , 光ファイバ端面のエアギャップ Z_c , 及びエアギャップ Z_c を消去するた めのフェルール端面の接触力 W_c は, いずれも斜め球面の傾斜角度 θ_1 の 関数として与えられる.

2) フェルールの接点 Q_c の光軸ZZに対する偏心 e_c は偏心 S_c の1乗の関数, エァギャップ Z_c は偏心 S_c の2乗の関数, フェルール端面の接触力 W_c は偏心 S_c の3乗の関数で与えられる.

3) 偏心 e_c , エアギャップ Z_c , 及び接触力 W_c は, 各々 $[R_1/(R_1+R_2)]$, $[(R_1+R_2)/2R_1\cdot R_2]$, 及び $[(R_1+R_2)/R_1\cdot R_2]$ の関数である. 斜め球面 頂点 P_c の光軸 ZZ に対する偏心 S_c のみが曲率半径 Rの関数となる.

<第7章>

4) 曲率半径 $R_1 \geq R_2$ に差異があるときは、曲率半径 $R_1 \geq R_2$ が同一の場合に比較して、偏心 e_c 、エアギャップ Z_c 、及び接触力 W_c は各々増加する、曲率半径 $R_1 \geq R_2$ の減少に伴って、偏心 e_c 、エアギャップ Z_c 、及び接触力 W_c は各々減少する.

5) APCコネクタにおいて、斜め球面の接点 Q_c の接触角度 ψ_c は、 斜め球面の傾斜角度 θ_1 ,及び斜め球面の曲率半径 R_1 と R_2 の関数である. また、 ψ_c の数値は常に θ_1 より小さい.

6) エアギャップ Z_c が消去できない場合の挿入損失ILは,各々フレネル損失 IL_F ,多重反射損失 IL_R ,及びエァギャップ Z_c の大きさによる光ファイバ減衰による損失 IL_A を合算したものになる.

第4章では、テーパ・フェルールが回転した状態で接続された場合の、 APCコネクタの形状特性、及び接続特性に関する普遍的な課題を明ら かにするために、フェルール回転角度φが0度から10度の範囲におい て、テーパ・フェルールの端面傾斜角度θ₁、斜め球面の曲率半径R₁と R₂などをパラメータとして、テーパ・フェルール付きAPCコネクタの 形状特性、及び接続特性に関する理論解析を行なった、解析結果は次の ように要約できる.

1) 曲率半径 R_1 , R_2 が同一の値の組合せの接続では, 偏心 e_c は, フェ ルールの回転角度 φ に, ほぼ直線的に比例して増加する. 一方, 曲率半 径 R_1 , R_2 に差異がある組合せの接続では, フェルール回転角度 φ が6度 以下の範囲においては, yy 座標上の偏心 e_{cy} の影響を受けて, 偏心 e_c はフェルール回転角度 φ に直線的には増加しない.

2) フェルール回転角度 φ が10度以下の範囲では、斜め球面の接点 Q_c の接触角度 ψ_c は、フェルール回転角度 φ による影響を殆ど受けない.

3) エァギャップ Z_c は, 斜め球面の傾斜角度 θ_1 , 曲率半径 $R_1 \ge R_2$, 及び フェルールの回転角度 φ の関数として与えられる.

4) エァギャップ Z_c を消去するための所要接触力 W_c は、斜め球面の傾斜角度 θ_1 ,曲率半径 R_1 と R_2 ,及び フェルールの回転角度 φ の関数

186

として与えられる.

5) 斜め球面の曲率半径 R_1 及び R_2 が異なる組合せの場合,特に,斜 め球面の端面傾斜角度 θ_1 が 12 度,及び曲率半径 R_1 , R_2 に差異がある 組合せの接続では、フェルール回転角度 ϕ が0 度においても、斜め球面 の接点 Q の光軸 ZZ からの偏心の yy 座標成分 e_{cy} により挿入損失 IL は 大きい値を示す.挿入損失 IL は光ファイバ端面間の多重反射による影 響により、その値は不規則に変化する.

以上の解析結果を再要約すれば、テーパ・フェルール付きAPCコネ クタの接続特性として、斜め球面の接点Q_cの偏心 e_c 、エァギャップ Z_c 、 および所要接触力 W_c は、フェルールの回転により拡大されると結論で きる.

第5章では、第3章、及び第4章で問題提起したテーパ・フェルール 付きAPCコネクタの課題を解決している.すなわち、第5章ではス テップ・フェルール付きAPCコネクタを新たに提案し、この新しいA PCコネクタについて、フェルール回転角度φ≥0°の条件における形 状特性、及び接続特性の理論解析を行って、その優位性を明らかにし た.更に、接続特性を改善するために、APCコネクタの構成部品の設 計仕様の改善を提案した.これらは、次のように要約できる.

1) 斜め球面の頂点 P_{s1}の光軸 ZZ からの偏心 S_sは, テーパ・フェ ルールに比較して1/15から1/35と無視できる程度に低減できる.

2) 斜め球面の接点 Q_s の光軸ZZからの偏心 e_s は、曲率半径 R_l , R_g の差異には無関係であり、偏心 e_s はフェルールの回転角度 φ にほぼ直線的に比例する.

3) 斜め球面の接点 Q_s の接触角度 ψ_s は、フェルールの回転角度 φ による影響を殆ど受けず微小である.

4) 光ファイバ端面間に生ずるエァギャップZ_sは,回転角度φの一 次関数として近似される. <第7章>

5) 所要接触力 W_s は, 斜め球面の傾斜角度 θ_1 , 斜め球面の曲率半径 $R_1 \ge R_2$, 及びフェルールの回転角度 φ の関数として与えられる.

6) フェルール回転角度 φによる挿入損失 ILの値は,フェルール回 転角度 φを超える領域では増加する.

第6章では,第3章から第5章に記述したテーパ・フェルール付きA PCコネクタ及びステップ・フェルール付きAPCコネクタの接続特性 の理論解析の結果を検証するために,次の3項目について挿入損失の実 験を行った.

(a) フェルールの先端形状及び回転角度 gによる挿入損失 IL

(b) フェルールの回転角度 φと増加挿入損失 *ΔIL*

(c) 繰り返し着脱特性

その結果は次のように要約できる.

1) フェルールの先端形状及び回転角度 φ による挿入損失 ILの実験 に関して、テーパ・フェルール付きAPCコネクタの挿入損失 ILが大 きな値を示す要因として、曲率半径 R_1 , R_2 に差異がある場合、フェル ールの回転角度 φ が0度においても接触力 W_c が大きくなり、ばね力 W_o では密着しない確率が増加することによる.

2) フェルールの回転角度 φと増加挿入損失 ΔILの実験に関しては, 実験値の方が理論値より約0.2 dB程度の良い数値を示しているが,こ の理由としては,実験値は初期値を0 dBとして計算したからである. その他の理由としては,石英ガラス製光ファイバのヤング率はジルコニ ア・フェルールの約1/2と小さいので弾性変形し易く,光ファイバの 半径より小さい領域を含めた接触力を考慮した場合,光ファイバ端面間 の密着させる接触力が小さめになることが考えられる.これらの要素を 考慮した場合,増加挿入損失 ΔILの実験データは理論計算式から求めた 挿入損失 IL の値にほぼ一致していると結論できる.

3) 繰り返し着脱特性に関しては,繰り返し着脱試験による挿入損失

ILのばらつき値 IL_{max},及び挿入損失の変化 AILの値は、フェルールの 回転角度 φが大きくなるほど増加する.一方、ステップ・フェルール付 きAPCコネクタの挿入損失のばらつき値 IL_{max},及び挿入損失の変化 AILの値は、テーパ・フェルール付きAPCコネクタの値に比較して小 さい値を示す.

以上の挿入損失に関する実験結果から,更に次のように再要約できる.

I) ステップ・フェルール付きAPCコネクタの挿入損失特性は, テーパ・フェルール付きAPCコネクタに比較して優れている.

Ⅱ) 挿入損失特性及び安定性は,回転角度を規制したコネクタ部品 を使用したAPCコネクタの方が優れている.

7.2 本研究成果の実績と応用

APCコネクタ用フェルールとしては,本研究の成果にもとずいて提 案されたステップ・フェルールは,ほぼ国際的に主流になっている.す なわち,ステップ・フェルールの形式は,1997年にIEC 874-14-7, SC/APCコネクタの国際規格に正式に採用された[1],[2].更 に,ステップ・フェルールに関する高橋の特許の通常実施権は,国内外 のフェルール製造者,及び需要者の数社に供与されている.

本研究により提案,実用化した光ファイバ端面の新しい球面成形研磨 方式における研磨原理,及び偏心盤の同期回転により研磨盤を公転させ る駆動機構は,近年に至って,他社から市場に新しく提供されるように なった球面成形研磨装置の設計標準となっている.[3],[4],[5],[6].た だし,高橋により提案された斜め球面成形研磨装置は,世界の70%以 上の市場占有率を保持している.

更に,本研究による研磨装置は,加工物を回転させないで鏡面ラッピ ングできる特徴をもっているので,本研磨装置の原理及び研磨装置の構 造は,加工物を回転できない形状,及び構造をもっている部品や材料の 鏡面ラッピング装置にも広く応用できる可能性を備えている.従って, 光コネクタ以外の光デバイス,及び一般の機械工業や電子工業分野へも 適用できるものと考えられる.

第7章参考文献

- International Electrotechnical Commission, "INTERNATIONAL STANDARD IEC-874-14-16. DETAIL SPECIFICATION FOR FIBRE OPTIC CONNECTOR TYPE SC-APC TUNED 9 DEGREES FOR SINGLE MODE FIBRE TYPE," published at May, 1997.
- International Electrotechnical Commission, "INTERNATIONAL STANDARD IEC-874-14-XX. "DETAIL SPECIFICATION FOR FIBRE OPTIC CONNEC-TOR TYPE SC-APC TUNED 8 DEGREES FOR SINGLE MODE FIBRE TYPE," May published within 1997.
- [3] "光コネクタ研磨機," OPTOCOM 誌, No. 83. (1996) 25-29.
- [4] "SP-500 POLISHING MACHINE OPERATION MANUAL," Siecor Co., LTD, Feb, 1997.
- [5] "APM Polishing Machine Operating Instruction," Domaille Engineering, INC, 1997.
- [6] "OFL12 シリーズ研磨機取扱説明書," セイコー電子工業株式会社, No. 39NPM-53EI-01, 1997.

本研究に関する発表論文

[有審查論文]

- [1] M. Takahashi, "Variable Light Attenuator of Improved Air-gap Type with Extremely Low Returning Light," Proc, IEEE IMTC/94, Vol. 2, pp. 947-950, (May. 1994).
- [2] M. Takahashi, "Compatibility of Conventional-Ferrule with Step-Ferrule for Angled Convex Optical Connectors," Proc, 45th IEEE ECTC, pp. 406-412, (May, 1995).
- [3] M. Takahashi," Novel Stepped ferrule for angled convex polished optical fiber connector," Proc, IEEE OFC' 95. Vol. 8, pp. 184-185, (Feb, 1995)
- [4] M. Takahashi, "Compatibility for optical connectors with different slanted angles at their ferrule endfaces," Proc, IEEE CLEO / Pacific Rim'95. pp. 304. (July, 1995).
- [5] 高橋光雄、"斜め球面研磨光コネクタの接続端面角度差異による互換性、"日本電子部品信頼性センタ、RCJ 第4回電子デバイスの信頼性シンポジューム、pp. 39 45、(11、1995)
- [6] M. Takahashi.:"Experimental Considerations for APC Optical Connectors with Slanted Angle of 8 degrees", Reports of The Graduated School of Electronic Science and Technology of Shizuoka Univ. Vol. 17, pp.89-95. (1996)
- [7] 高橋光雄, "光ファイバ端面の斜め球面研磨装置とその研磨実験,"
 精密工学会,(1996年4月投稿.1997年7月見直し再提出).
- [8] M. Takahashi, "Elastic Polishing Plate Method and Conditions for Forming Angled Convex Surface on Ferrule Endface," IEEE Journal of Lightwave Technology. Vol. 15, No. 9, pp. 1675 - 1680, September, 1997.
- [9] M. Takahashi, "Generating Mechanism of Maintaining Force for Optical Fiber Installed in Ferrule Hole," IEEE Journal of Lightwave Technology. (Accepted subject to minor revision, October, 1997. Assigned No, 3250)
- [10] M.Takahashi, "Improved Design of APC connector with Slanted Angle of 12

degrees for Dispersion Shifted Optical Fiber," IEEE Journal of Lightwave Technology. (Accepted subject to minor revision, October, 1997. Assigned No. 3371).

- [11] M. Takahashi, "Connections of APC Optical Connectors with Stepped-Ferrules," IEEE Journal of Lightwave Technology. (Submitted in August, 1997. Assigned No. 3610)
- [12] 高橋光雄、"斜め球面接続光コネクタ用ステップ・フェルールの回転 ずれによる挿入損失の増加、"電子情報通信学会論文誌 CーⅡ、 (1997年11月条件付採録決定).

[口頭発表論文]

- [13] 高橋光雄, "光コネクタの温度特性に及ぼす要因の一考察," 電子情報通
 信学会. Vol. R95-45, pp. 57-62. (02, 1996)
- [14] 呉玉英, 高橋光雄, "高性能型光分波器," 電子情報通信学会.1997総合大会, pp. C-3-47.

本研究内容が採録された国際規格

- International Electrotechnical Commission, "INTERNATIONAL STANDARD
 IEC-874-14-16. DETAIL SPECIFICATION FOR FIBRE OPTIC CONNECTOR
 TYPE SC-APC TUNED 9 DEGREES FOR SINGLE MODE FIBRE TYPE,"
 Published in May, 1997.
- [2] International Electrotechnical Commission, "INTERNATIONAL STANDARD IEC-874-14-XX. "DETAIL SPECIFICATION FOR FIBRE OPTIC CONNECTOR TYPE SC-APC TUNED 8 DEGREES FOR SINGLE MODE FIBRE TYPE," To be published by the end of 1997.

193

本研究に関する取得特許

(日本及びEU特許は重複するので, US Patentのみ記載)

- M. Takahashi, "Optical Fiber Connector," US Patent. No. 4,747,659. May 23, 1989.
- [2] M. Takahashi, "Optical Fiber Connecting Device," US Patent. No. 4,953,941.Sept 4, 1990.
- [3] M. Takahashi, "Optical Fiber end-surface Polishing Device," US Patent. No.
 4,979,334. Dec 25, 1990.
- [4] M. Takahashi, "Variable Optical Light Attenuator," US Patent. No. 5,066,094.Nov 19, 1991.
- [5] M. Takahashi, "Optical Power Attenuator of Variable Attenuation Type," US Patent. No. 5,136,681. Aug 4, 1992.
- [6] M. Takahashi, "Optical Connector Ferrule," US Patent. No. 5,140,660. Aug 18, 1992.
- [7] M. Takahashi, "Method and Apparatus for Grinding Foremost End Surface of a ferrule", US Patent. No. 5,216,846. June 8, 1993.
- [8] M. Takahashi. "Method for Grinding Ferrules For Ribbon Type Optical Connectors," US Patent. No. 5,265,381. Nov 30, 1993.
- [9] M.Takahashi, "Optical Fiber Termination Device," US Patent. No. 5,337,377.Aug 9, 1994.
- [10] M. Takahashi. "Apparatus For Grinding Endfaces of Ferrules Together with Optical Fibers Each Firmly Received in Ferrule," US Patent. No. 5,351,445. Oct 4, 1994.
- [11] M. Takahashi, "Optical Demultiplexing/Multiplexing Device," US Patent. No. 5,400,421. Mar 21, 1995.
- [12] M. Takahashi, "Light Attenuating Element and Method of Producing the same," US Patent. No. 5,267,342. Jul 2, 1996.
- [13] M. Takahashi, "Optical Fiber End-Surface Polishing Device," US Patent. No. 5,547,418. Aug 20, 1996.

付録 1

A.1 分散シフト光ファイバの反射戻り光特性

A.1.1 分散シフト光ファイバ

石英系シングルモード光ファイバの伝送損失が1.550 µm帯で最小で あることを生かして,大容量(高速でもある)の光信号の通信を行うに は,分散も1.550 µm帯で最小にしなければならない.このためには, 光ファイバの屈折率分布形状を変えて構造分散を変え,ゼロ分散波長を 1.550 µm帯にシフトさせる.このとき,カットオフ波長は勿論1.550 µm以下にする.これが分散シフト光ファイバであるが,通常のシング ルモード光ファイバに適用されているステップ・インデックス形で分散 をシフトさせるとすると,光ファイバのモードフィルド直径が5 µm以 下となって実用的でない.そこで,図A.1.1 (a)の通常のステップ・イ ンデックス形シングルモード光ファイバの屈折率分布ではなく,図 A.1.1 (b)のような屈折率分布をもつデュアル・コア形の構造のものが 日本では実用化されている[1],[2].

この場合,分散シフト光ファイバのモードフィルド直径は約8~8.2 µmであり,通常のステップ・インデックス形シングルモ-ド光ファイ バのモードフィルド直径である約9~9.2 µm に比較して小さくなる. 更に,ジルコニア・フェルールに組み込まれた光ファイバは,エポキシ 接着剤のキュアリング温度以下の温度領域では,直径方向の圧縮応力に より,見かけのモードフィルド直径は,温度に応じて若干小さくなる [3],[4].

ここで,光ファイバ端面からの反射戻り光B_Rは第1章の式(1.5)で 与えられる[5],[6].

図A.1.2は、ステップ・フェルールに分散シフト光ファイバを組み込んで、斜め球面の傾斜角度 θ_1 を8度から12度まで1度おきに変えて成形研磨したAPCコネクタについて行った反射戻り光の実験値をプロットしたものである[7].図A.1.2では、光の波長を1.310 μ m及び1.550 μ mの2種類についての反射戻り光 B_R を測定した.図A.1.2から、反







因 A.1.2 分散シノトルファイバ $A P C コ イクタの斜め球面の傾斜角度 <math>\theta_1$ の変化による反射戻り光 B_R の実験値

射戻り光 B_{R} を-60 dB以下にするに要する斜め球面の傾斜角度 θ_{I} は, 光の波長が1.310 μ m については約10度以上,及び1.550 μ m につい ては11 度以上になる.

付録 2

図A.2.1 (a),(b)は,本研究の成果である,"同期回転する偏心盤に よる研磨盤の公転駆動方式,"と"弾性研磨盤,"を採用して構成された 他社の球面研磨装置の例の写真である[7]-[10].



(a). A.

(b). B.

図 A.2.1 "同期回転する偏心盤による研磨盤の公転駆動方式,"を 採用した他社の球面研磨装置の例

付録参考文献

- [1] 大久保勝彦, "ISDN時代の光ファイバ技術," 利理工学社, pp. 4/ 10-4/11, 1989.
- [2] 重松昌行,他,"1.55mm帯分散シフトファイバの開発,"住友電 工,vol. 130, pp. 1-6, 1987.
- [3] M. Takahashi, "Generating Mechanism of Maintaining Force for Optical Fiber Installed in Ferrule Hole," IEEE Journal of Lightwave Technology. (Accepted subject to minor revision, October, 1997. Assigned No, 3250).
- [4] 高橋光雄, "光コネクタの温度特性に及ぼす要因の一考察," 電子情報通 信学会. Vol. R95-45, pp. 57-62. (02, 1996)
- [5] D. Marcuse, "Loss Analysis of Single-Mode Fiber Splices," Bell System Tech' Journal, Vol. 56, No. 5, p. 713, 1977.
- [6] M. Takahashi, "Variable Light Attenuator of Improved Air-gap Type with Extremely Low Returning Light," Proc, IEEE IMTC/94, Vol. 2, pp. 947-950, (May. 1994).
- [7] M. Takahashi, "Connections of APC Optical Connectors with Stepped-Ferrules," IEEE Journal of Lightwave Technology. (Submitted in August, 1997. Assigned No. 3610)
- [8] "光コネクタ研磨機," OPTOCOM 誌, No. 83. (1996) 25-29.
- [9] "SP-500 POLISHING MACHINE OPERATION MANUAL," Siecor Co., LTD, Feb, 1997.
- [10] "APM Polishing Machine Operating Instruction," Domaille Engineering, INC, 1997.
- [11] "OFL12 シリーズ研磨機取扱説明書," セイコー電子工業株式会社, No. 39NPM-53EI-01, 1997.

謝 辞

本研究をまとめる機会を与えて頂き,国際会議での発表の場のご紹介 並びにサポートを頂き,また,論文の取りまとめに際して,ご懇切なご 指導を賜わった静岡大学工学部の池田弘明教授には心から感謝申し上げ ます.同時に,光学に関するご懇切な講義をして頂いた久保高啓教授, 皆方誠教授,篠原茂信教授に深く感謝申し上げます.

本論文の取りまとめのために,大学院入学の動機付けを頂いた井ノ口国際特許事務所の井ノロ寿所長に深く感謝申し上げます.

学内において,事務処理,通信連絡その他の用件で,お世話を頂いた, 研究室の吉田博文技官,澤木年子教務員に深く感謝申し上げます.

暖かいご鞭撻並びにご支援を頂き,また,支障のないように業務上の 便宜を取り計らって頂いた国内外の顧客先の皆様に深く感謝申し上げま す.特に,高橋の国際会議における論文発表に際してご支援を頂いた, 年来の友人である Dr. Joseph Straus に深く感謝申し上げます.

私的には、本論文の実験データの作成.並びに論文のとりまとめにご協力頂き、また、業務に支障のないように私を支えて頂いた株式会社精工技研の役員、及び社員の皆様に感謝いたします.